

XAFSと他の手法を併用した触媒作用機構研究 : 排ガス浄化、水素化、アルカン脱水素を例に

(北海道大) 清水 研一

内容

1. 三元触媒: 担体(La)とPdの界面協働作用
2. NH₃-SCR用Cu-CHA: 還元・再酸化素過程のoperando分光研究
3. リーンNO_x吸着剤(Pd-CHA): NOによるバルクPdの原子状分散
4. SCR用Ag/Al₂O₃: 雰囲気変動によるAgの可逆的凝集・再分散
5. In-zeolite: 金属ヒドリドを活性種とするアルカン脱水素機構

謝辞

鳥屋尾 隆 助教

前野 禅 特任講師

Chong Liu (JSPS-PD)

Yuan Jing (D1)

安村 駿作 (D1)

窪田 博愛 (D1)

PdLa/Al₂O₃

PdCHA, 脱水素

DFT

PdLa/Al₂O₃

PdCHA, 脱水素

CuCHA, Ag/Al₂O₃

自己紹介

2000年 名古屋大学・工・博士 @服部 忠 研究室

2000年 新潟大学・工・助手 @北山 淑江 研究室

2004年 名古屋大学・工・助教 @薩摩 篤 研究室

2010年 北大・触媒センター・准教授@独立

2015年 北大・触媒科学研究所・教授



謝辞

分光の先生

名大

京大

JASRI

工学院大

京大

薩摩 篤先生

吉田 寿雄先生

本間 徹生様

加藤 和男様

奥村 和先生

朝倉 博行先生

▪▪ operando IR, UV-vis

▪▪ 普通のXAFS

▪▪ in situ XAFS

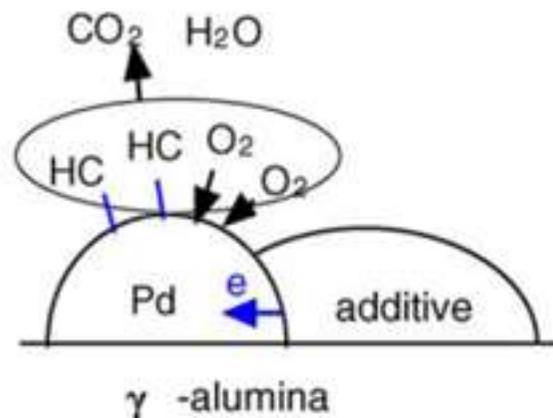
▪▪ operando XAFS

1. Pd/La-Al₂O₃ for TWC

Laは Al₂O₃の焼結防止剤

三元触媒活性に対する効果は？

Pd catalyst with additive (La)

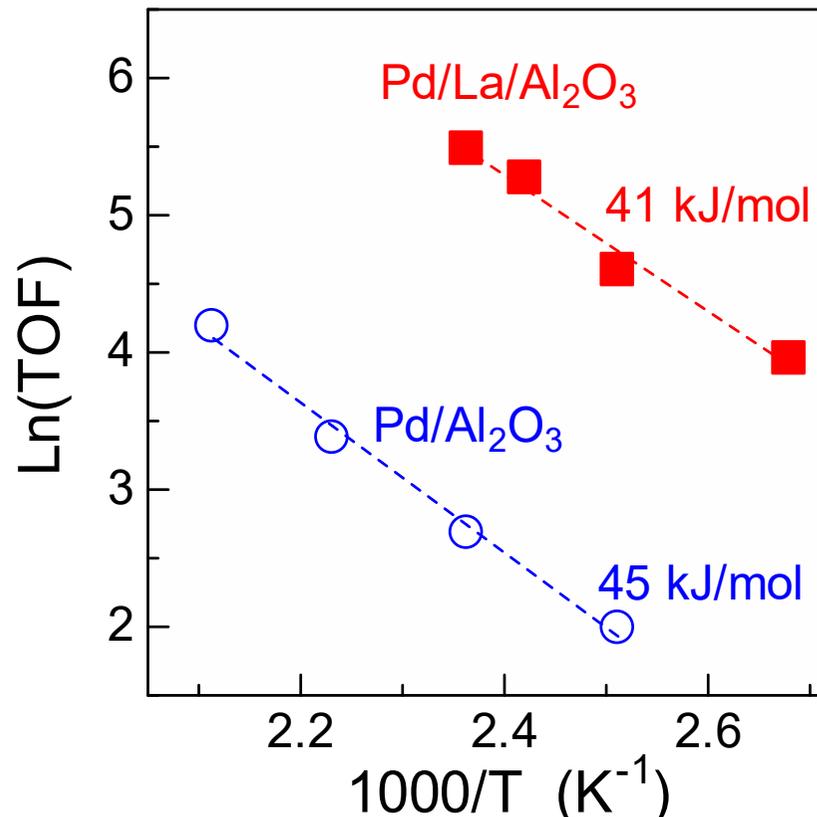
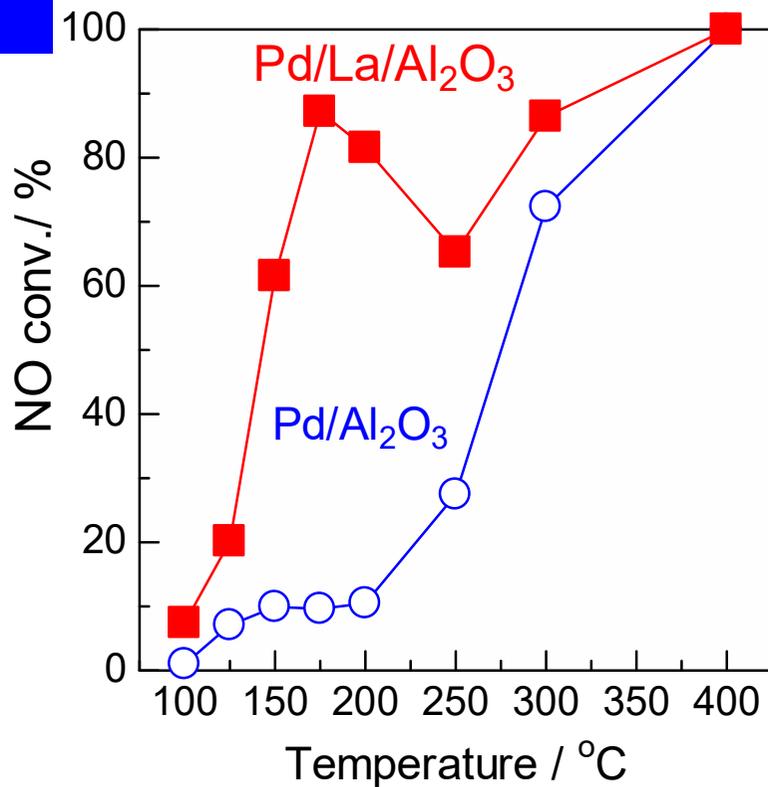


Pd上への炭化水素の強吸着を抑制

H. Muraki, et al., I&EC, **1986**, 25, 202

H. Muraki, et al., Appl. Catal., **1989**, 48, 93

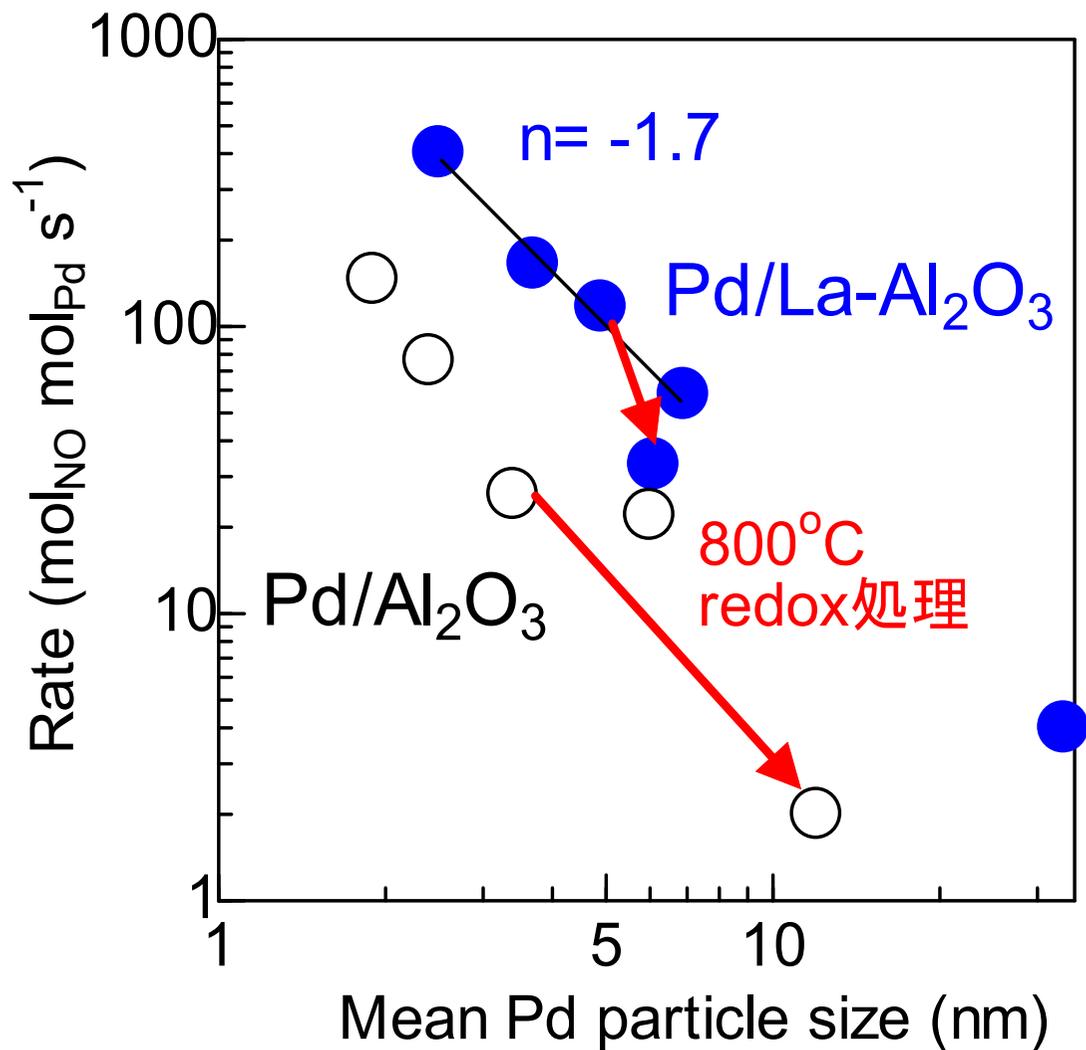
発見！



- ・LaがPd/Al₂O₃のNO-CO反応を促進した！
- ・低温ではN₂Oが主に生成



Laには焼結抑制(アンカー効果)、活性向上、2つの効果がある!

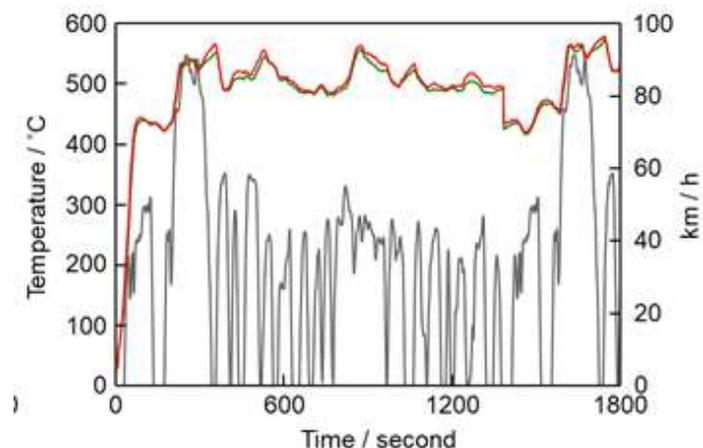


排ガス規制モード(US・LA-4)走行試験



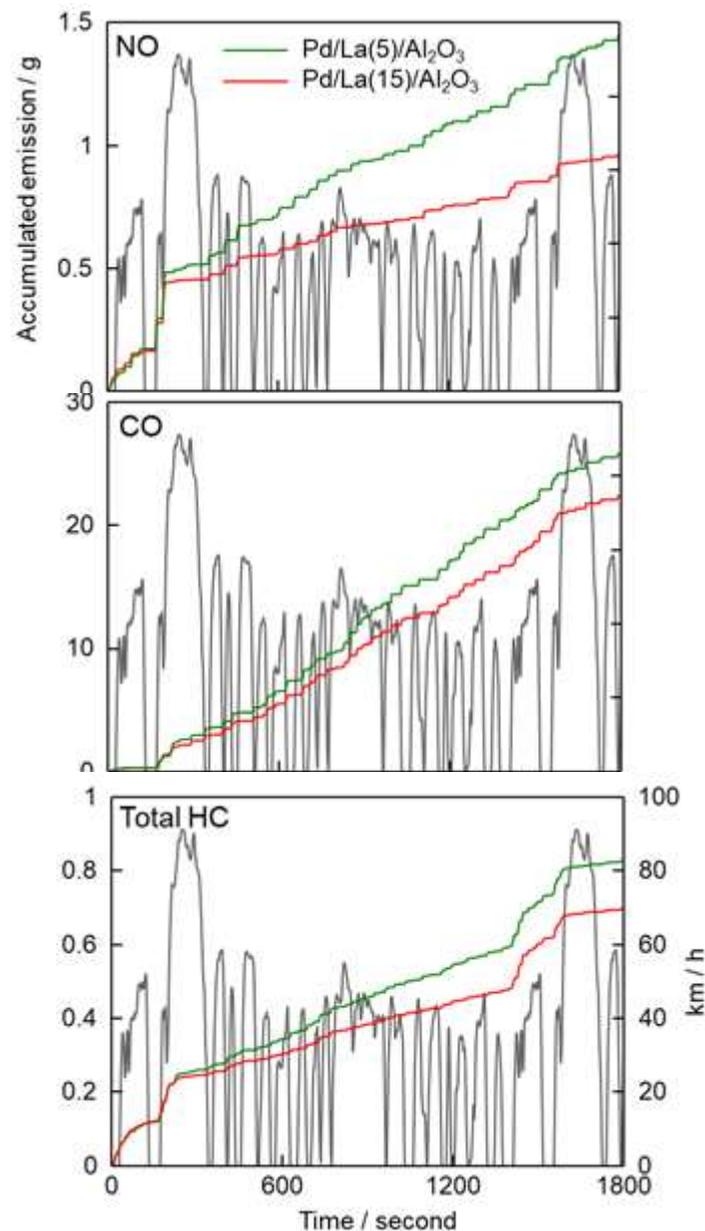
Pd-Rh系2層三元触媒(下層: Pd, 上層: Rh)を
市販のガソリン自動車(1.5 L)に搭載

※試験前に、最大温度950 °C・75時間の劣化処理を実施



Catalyst 1.0 g / in³; Cordierite 25.4 x 50 mm (1.55 in³)

※ in³ = 1.64 x 10⁻² L



調製、構造

Synthesis of La(X)/Al₂O₃
(Impregnation method)

γ-Al₂O₃
La(NO₃)₃
H₂O

Impregnation of γ-Al₂O₃ powder into
La(NO₃)₃ aqua solution
Drying in air at 120 °C for 2 h
Calcination in air at 600 °C for 2 h

La(X)/Al₂O₃ (X = 5, 15, 30 wt.%)

Synthesis of Pd/La(X)/Al₂O₃
(Impregnation method)

La/(X)Al₂O₃
Pd nitrate aq.
H₂O

Stirring at r.t. for 15 min.
Evaporation under vacuum at 50 °C
Drying at 90 °C for 12 h
Calcination in air for 3 h
H₂ reduction at 500 °C for 0.5 h

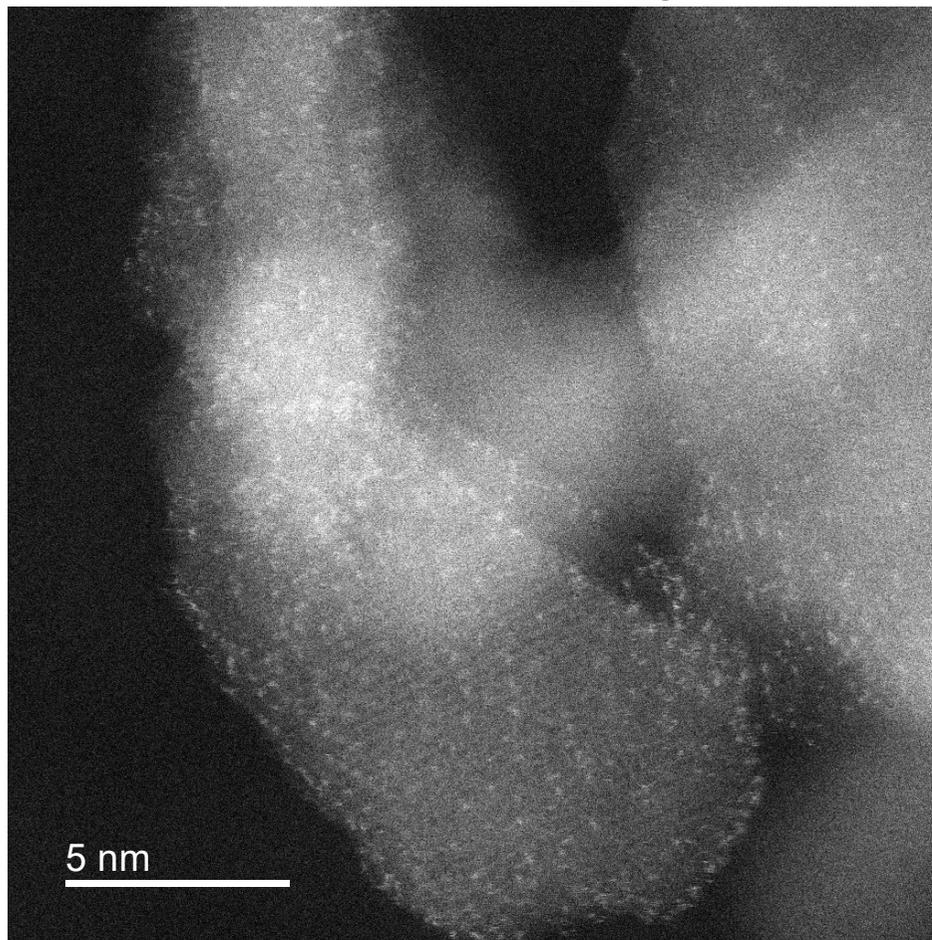
Pd/La(X)/Al₂O₃ (Pd = 1wt.%)

Catalyst	T _{Calcination} / °C	T _{H2 reduction} / °C	S _{BET} / m ² g ⁻¹	Pd size ^b / nm
Pd/Al ₂ O ₃	500	500	156	3.4
Pd/La(15)/Al ₂ O ₃	500	500	129	3.7

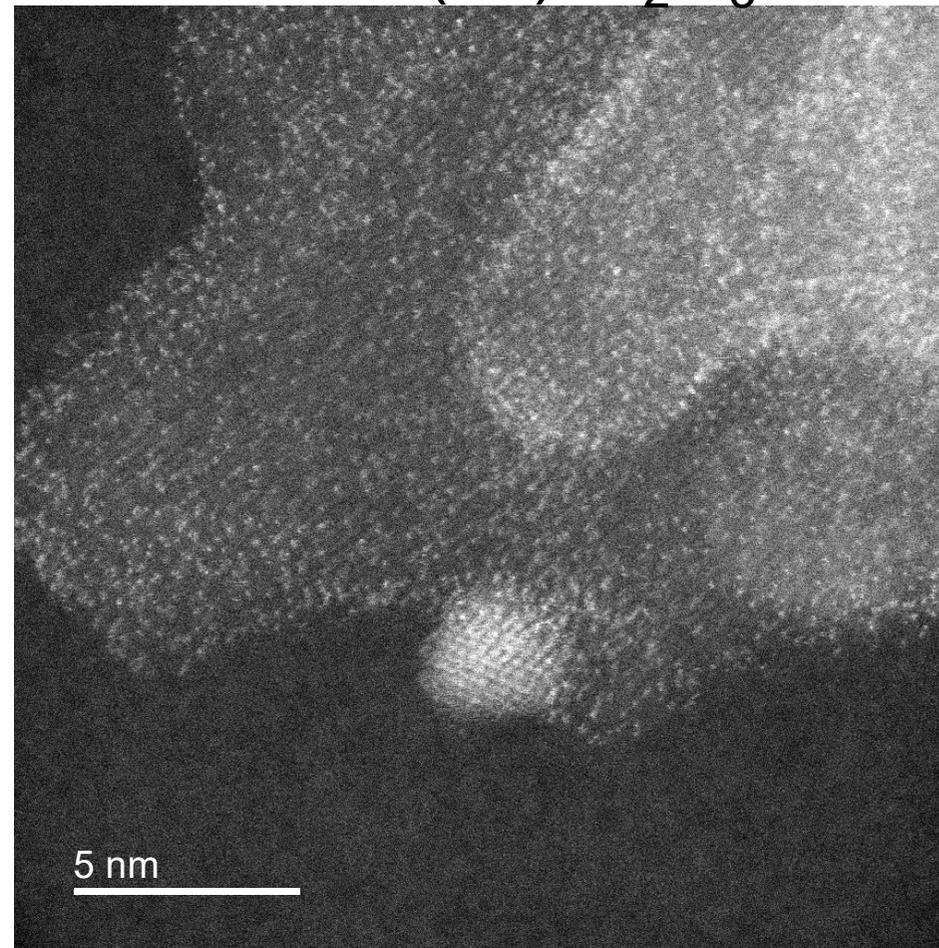
^aPd loading amount = 1 wt.%. ^bEstimated from the CO adsorption experiments.

HAADF-STEM

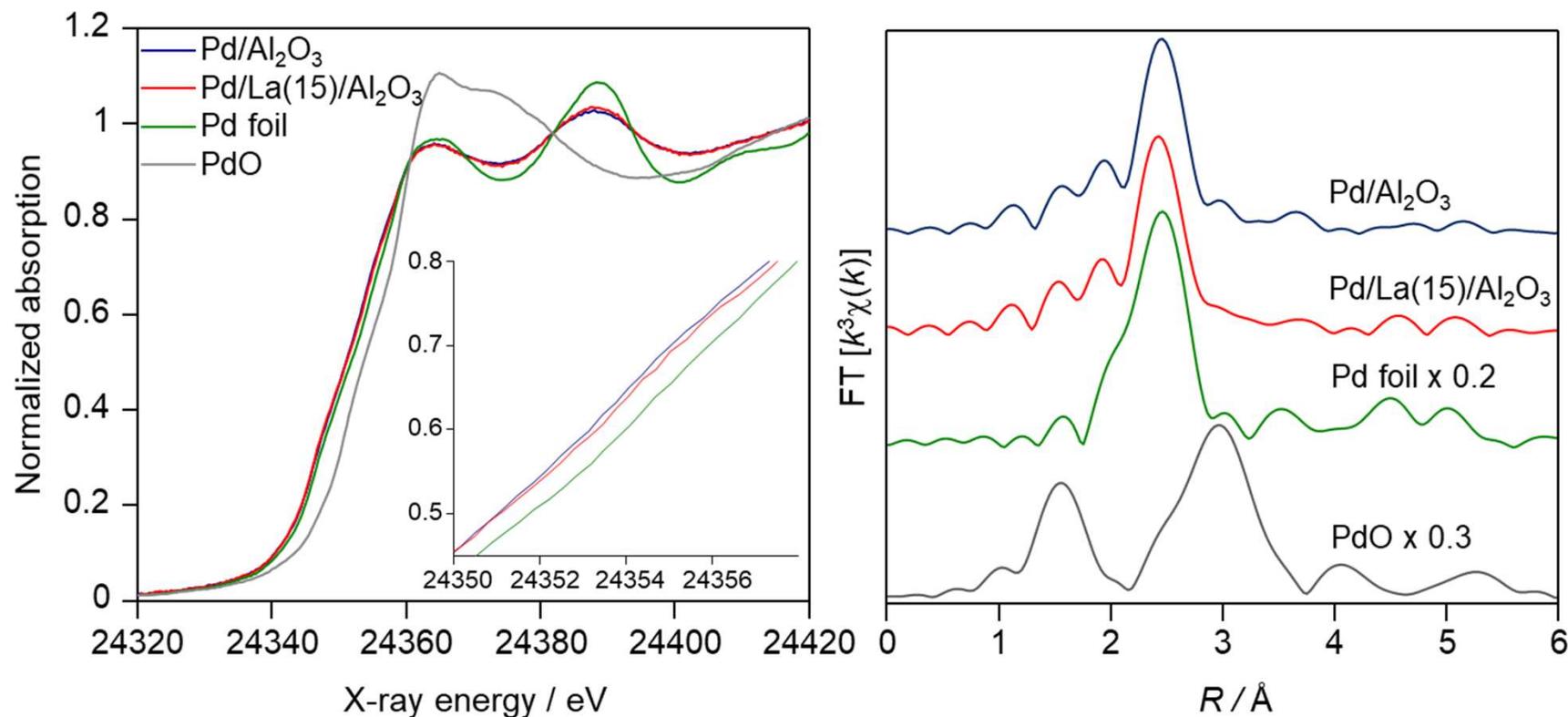
La(15)/Al₂O₃



Pd/La(15)/Al₂O₃



Pd-K edge XAFS



Measured under a flow of 5% H₂/He at 200 °C. The catalyst was pretreated under a flow of 5% H₂/He (200 cm³ min⁻¹) at 400 °C for 0.5 h, followed by cooling to 200 °C.

Sample	Shell	N ^a	R (Å) ^b	σ (Å) ^c	R _f (%) ^d
Pd/Al ₂ O ₃	Pd-Pd	3.1	2.67	0.11	0.4
Pd/La(15)/Al ₂ O ₃	Pd-Pd	3.3	2.67	0.10	0.5

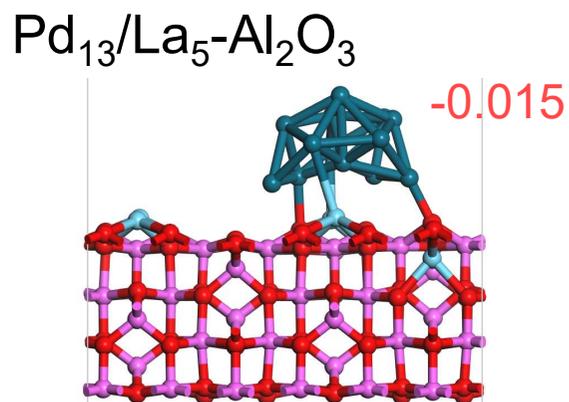
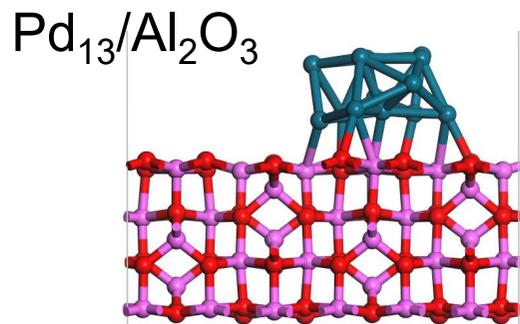
^a Coordination numbers. ^b Bond distance. ^c Debye-Waller factor. ^d Residual factor.

EXAFS・・・Pdは金属状態

XANES・・・La添加で、高エネルギー側にシフト→Pdはちょっと電子不足

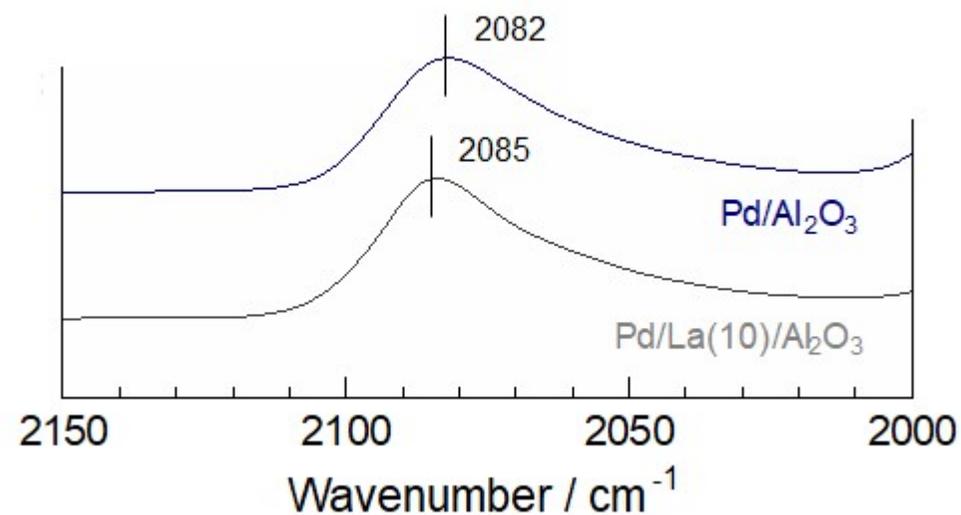
DFT, CO吸着IR

Total Bader charge of Pd₁₃ = -0.036

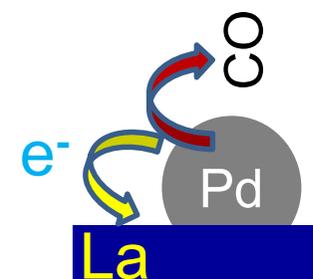


Laにより、
Pd₁₃の負電荷は減少

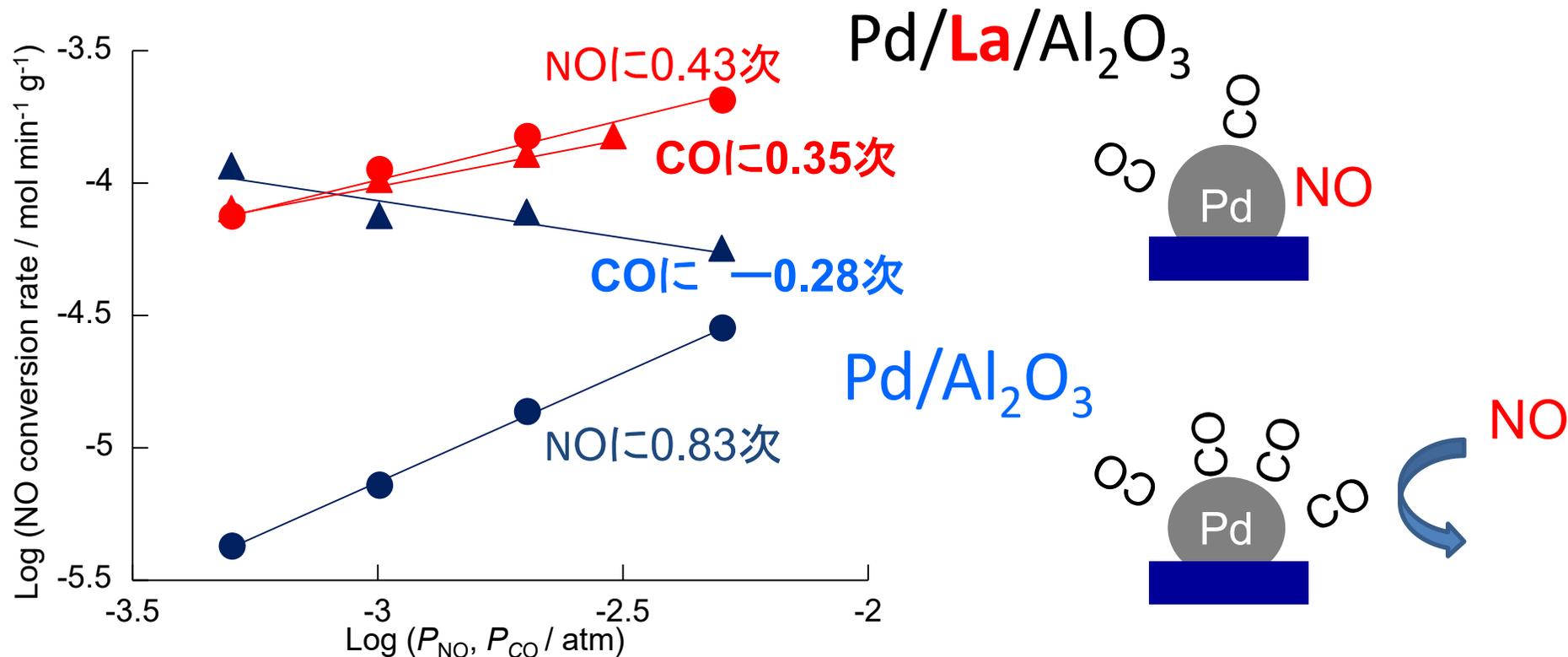
Laにより、Pdが電子不足になり、
CO_{ad}の吸着が弱まる



Laにより
CO_{ad}の振動は高波数シフト



NO, CO分圧依存(150°C)



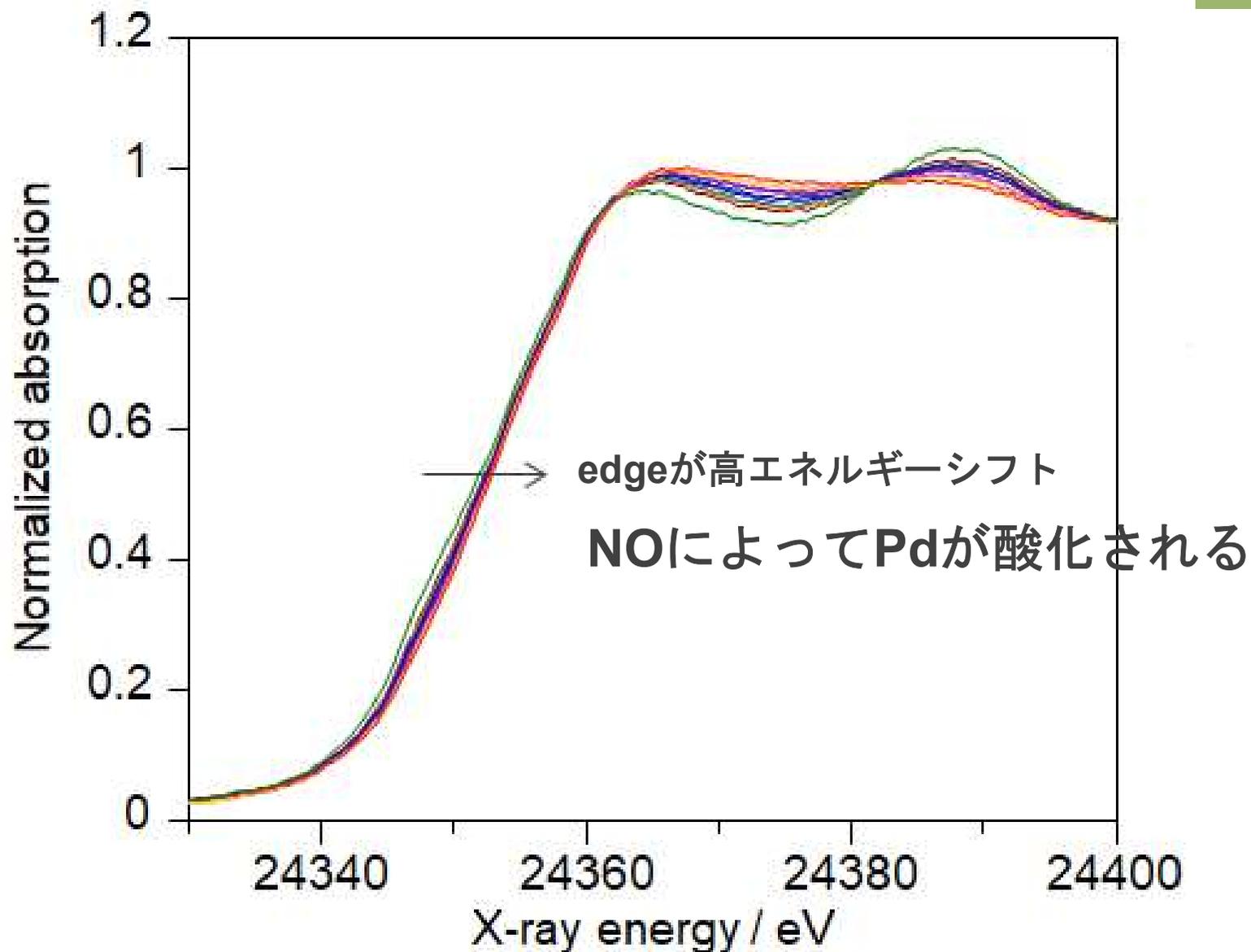
La添加により、NOの次数は、減少 (0.83 → 0.43)
COの次数は、負から正に増加 (-0.28 → +0.35)

【考察】

- ・ La無しの場合、強く吸着したCOがNO活性化を阻害
- ・ LaがPdを電子不足に→CO被覆率を減少→NO還元を促進

NO流通(200°C)中のin situ XANES

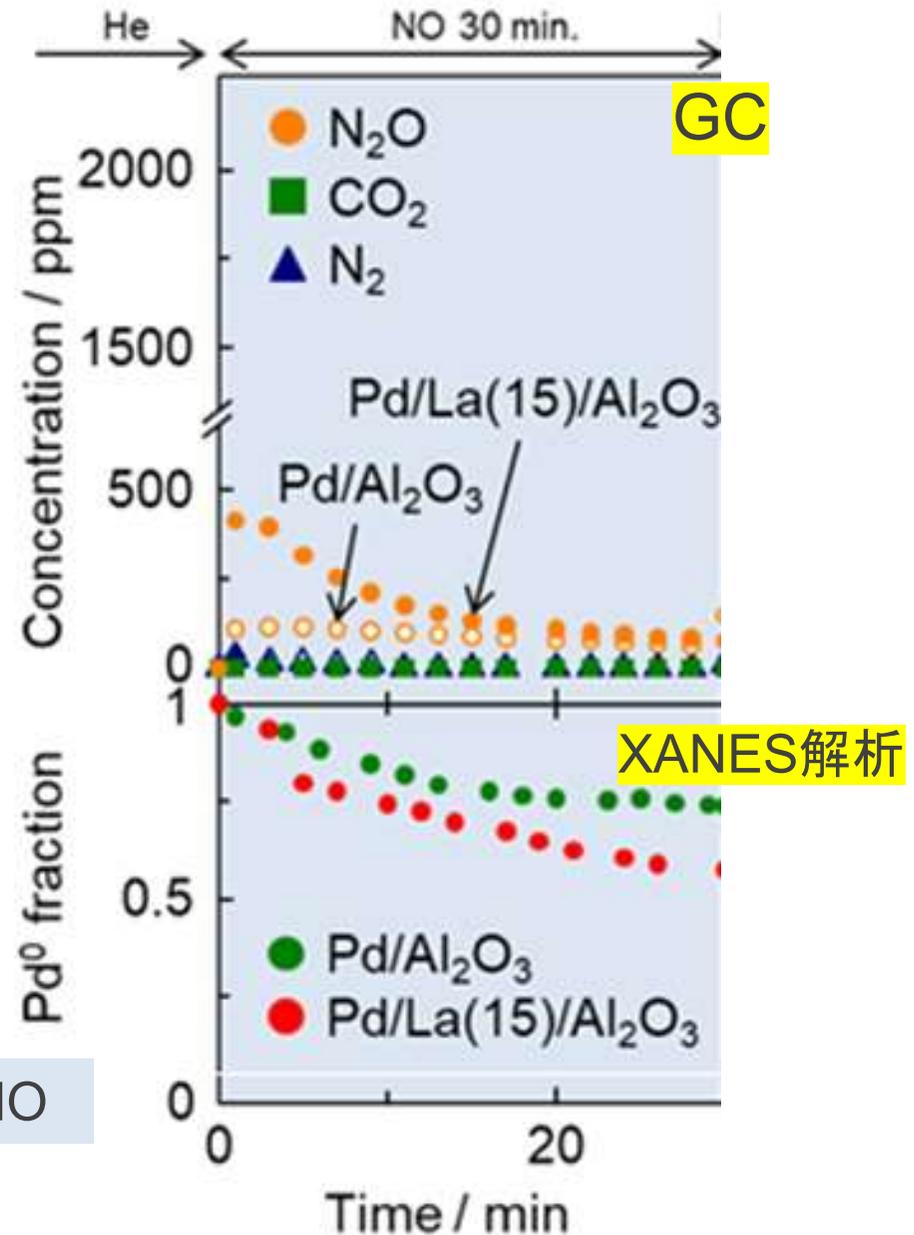
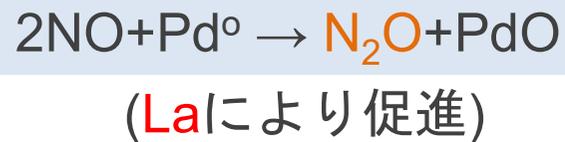
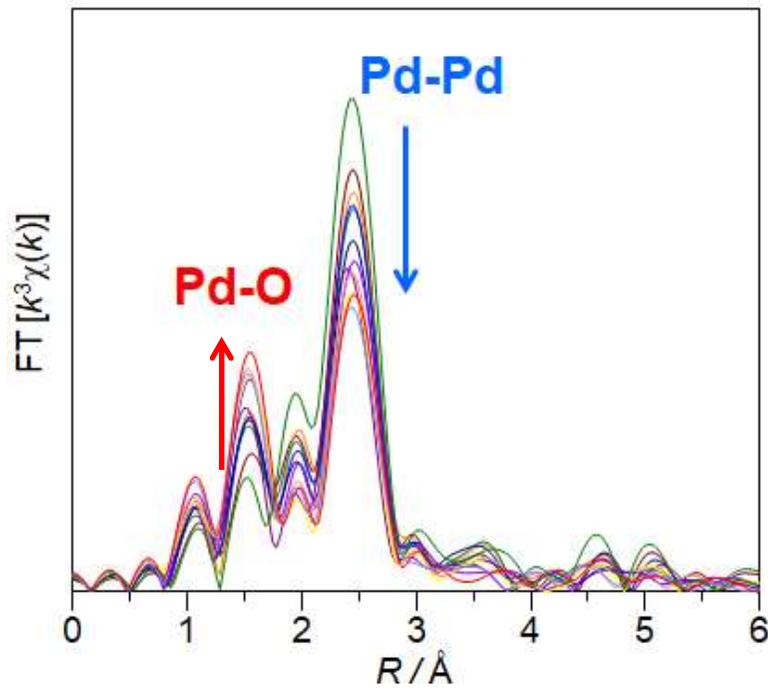
Pd/La(15)/Al₂O₃
0.5% NO/He



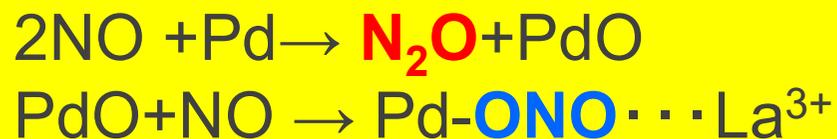
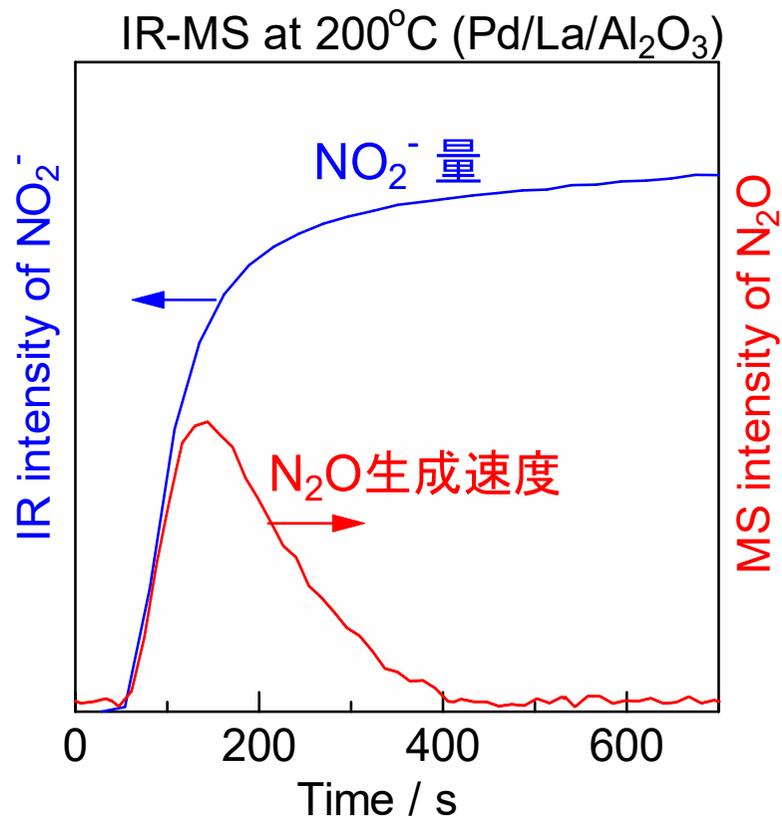
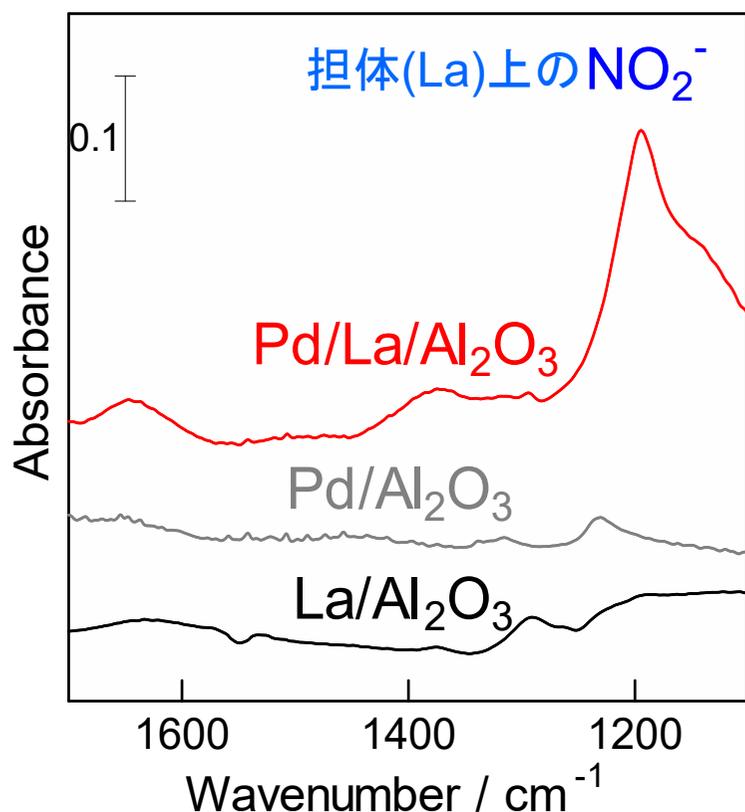
Measured in a transmittance mode at the BL01B1 at 200 °C; Acquisition time for one XAFS spectrum = ~2 min; 400 mg of Pd/Al₂O₃ or Pd/La(15)/Al₂O₃ with pellet forms (φ10 mm); Pretreatment: 5% H₂/He (200 cm³ min⁻¹) at 400 °C for 0.5; Total flow rate = 800 cm³ min⁻¹; SV = ~30,000 h⁻¹.

NO流通中のXAFSと出口ガス分析 (謝辞: 京都大学 朝倉博行先生)

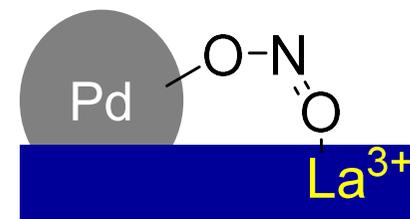
NOによってPdが酸化される



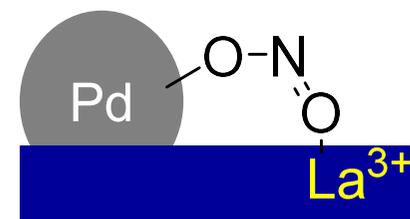
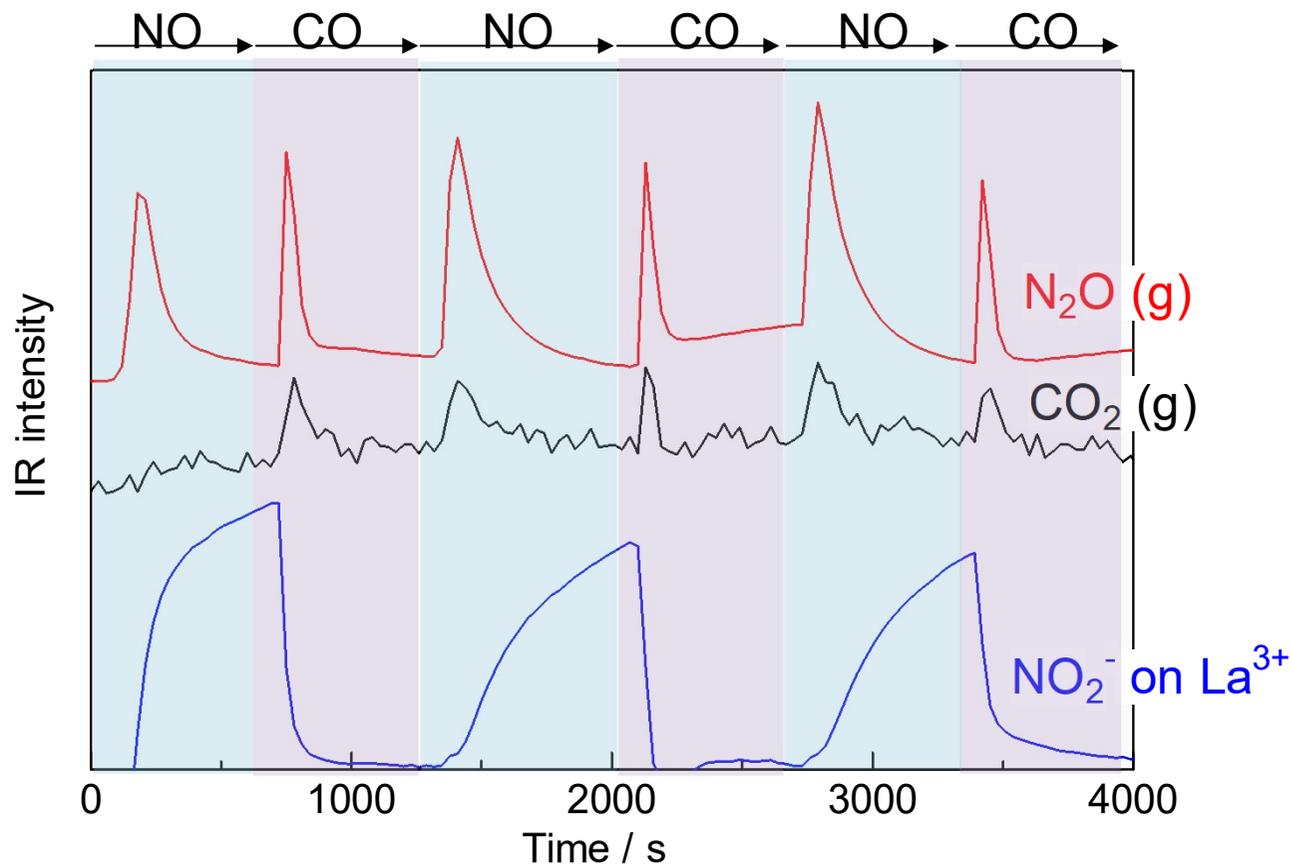
ラボに戻って、IR-MSで、触媒とNOの反応を観ると



Pdと担体のLa(Lewis酸)界面以外に
この反応を起こせる反応場はない！

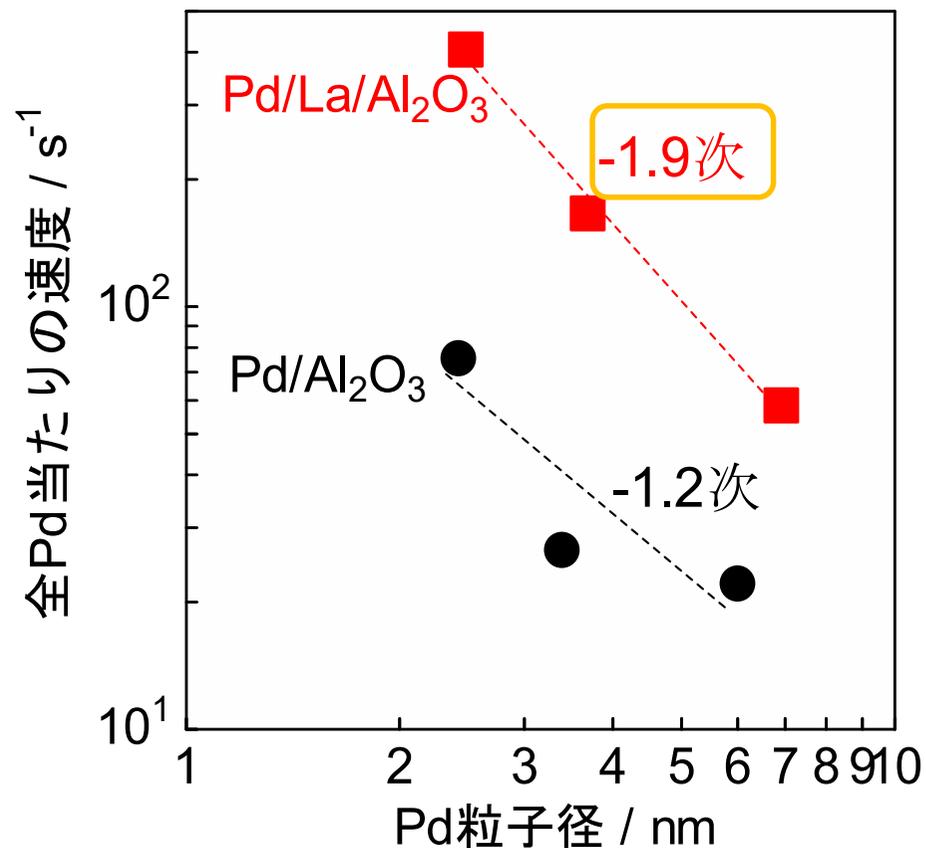
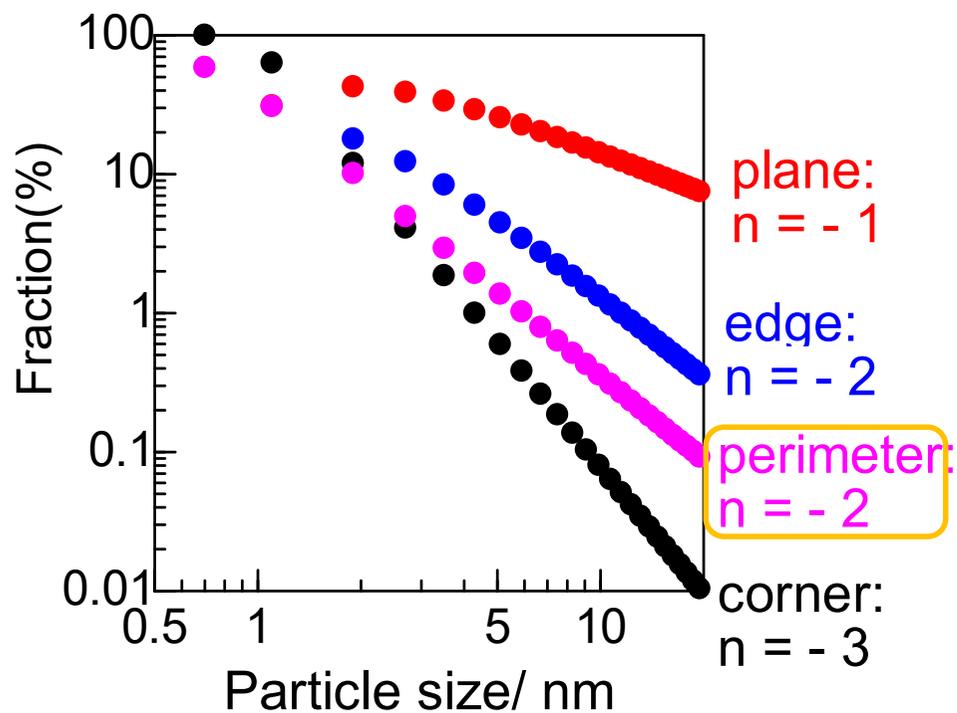


NO⇌CO繰返し導入。非定常だが、連続的な低温脱硝がおこる



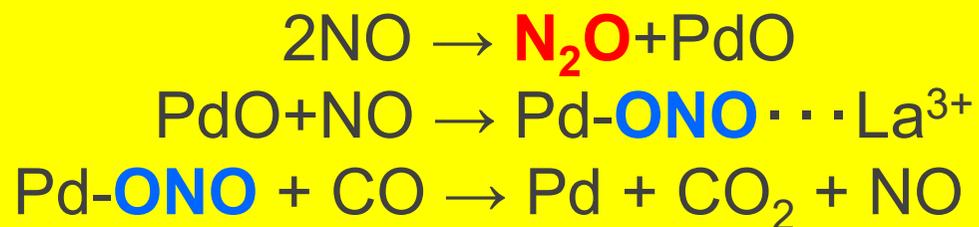
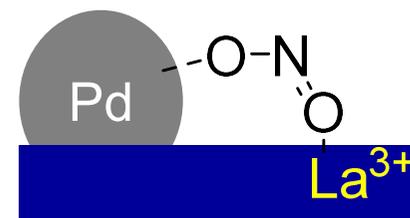
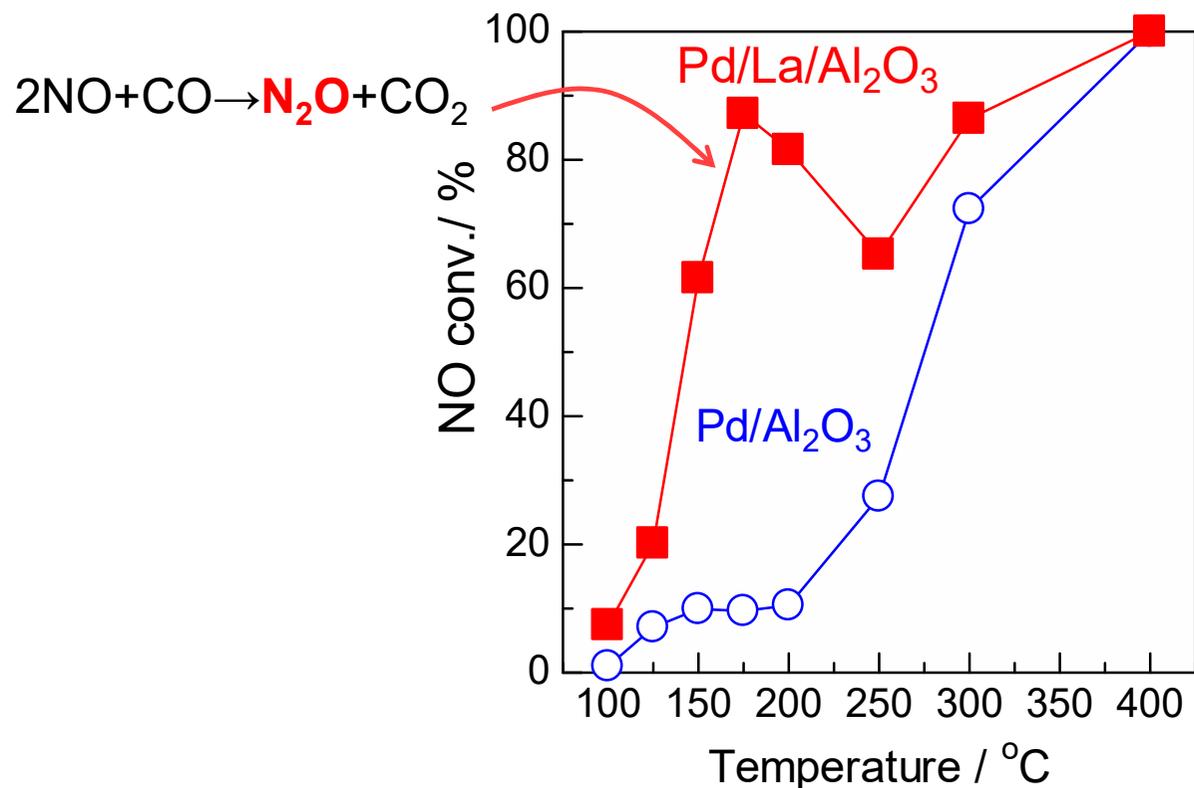
Pdと担体のLa(Lewis酸)界面以外にこの反応を起こせる反応場はない

界面のPdが活性サイトの場合、速度は粒径に -2 次 で依存



Pdと担体のLa(Lewis酸)界面が活性サイト

Pdと担体Lewis酸の界面で低温NO還元が進行



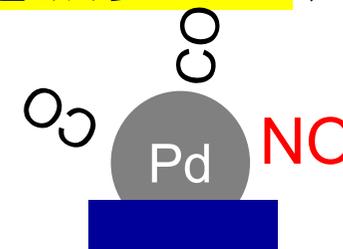
まとめ(3つのLa効果)

1. Pdのシンタリング抑制

2. 電子的効果

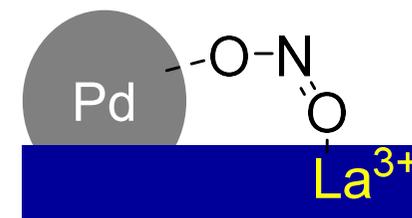
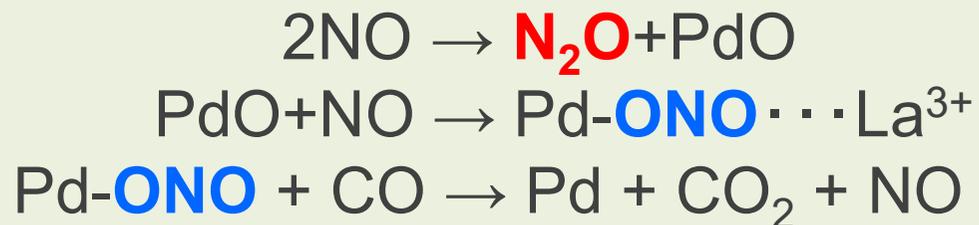
La無しの場合、COがNO吸着を阻害

Laが、Pdを電子不足にすることで、CO被覆率を減少させ、結果的にNOの活性化を促進



3. 界面での協働作用

Pd-La界面でNOが不均化。NO₂をLaが一旦安定化するため、低温での $2\text{NO} + \text{CO} \rightarrow \text{N}_2\text{O} + \text{CO}_2$ 反応が可能に



T. Toyao, *ACS Catal.*, 2020

NH₃-SCR用Cu-AFX: 還元・再酸化素過程のoperando分光研究

謝辞

横国 窪田好浩先生

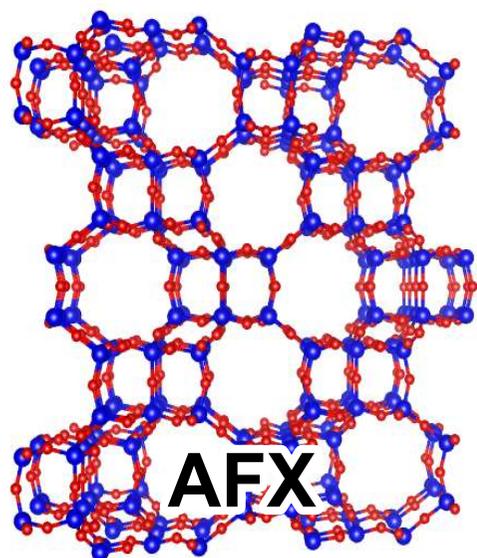
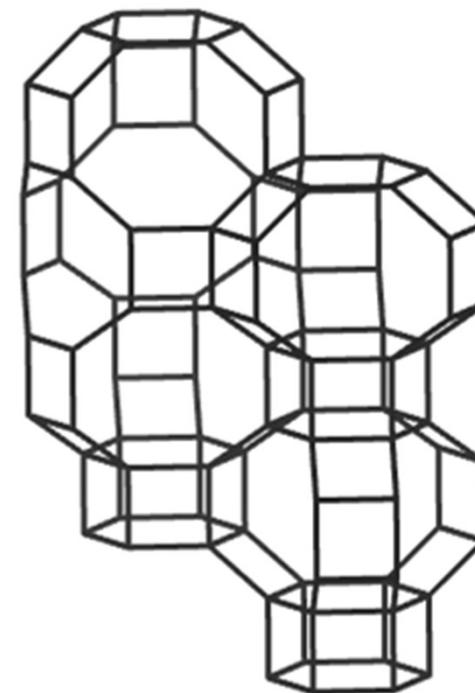
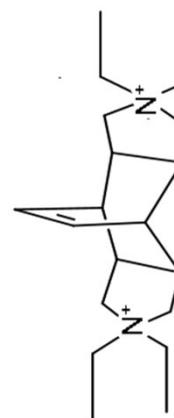
東大 小倉 賢先生

名大 薩摩 篤先生・・in situ UV-vis

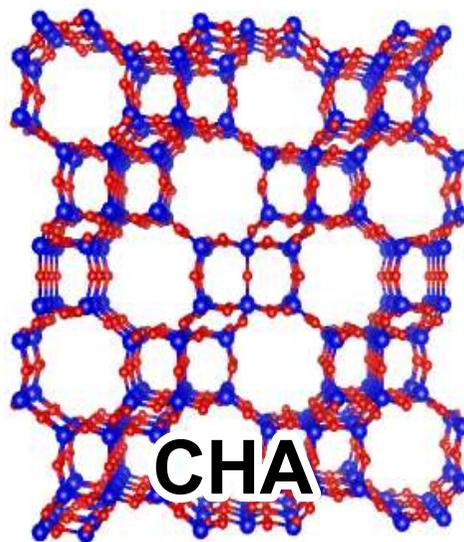
京大 朝倉博行先生・・in situ XAFS



Sample	Si/Al	Cu/wt%	Cu/Al
Cu-AFX	5.3	4.1	0.32



AFX

 $3.4 \times 3.6 \text{ \AA}$ 

CHA

 $3.8 \times 3.8 \text{ \AA}$

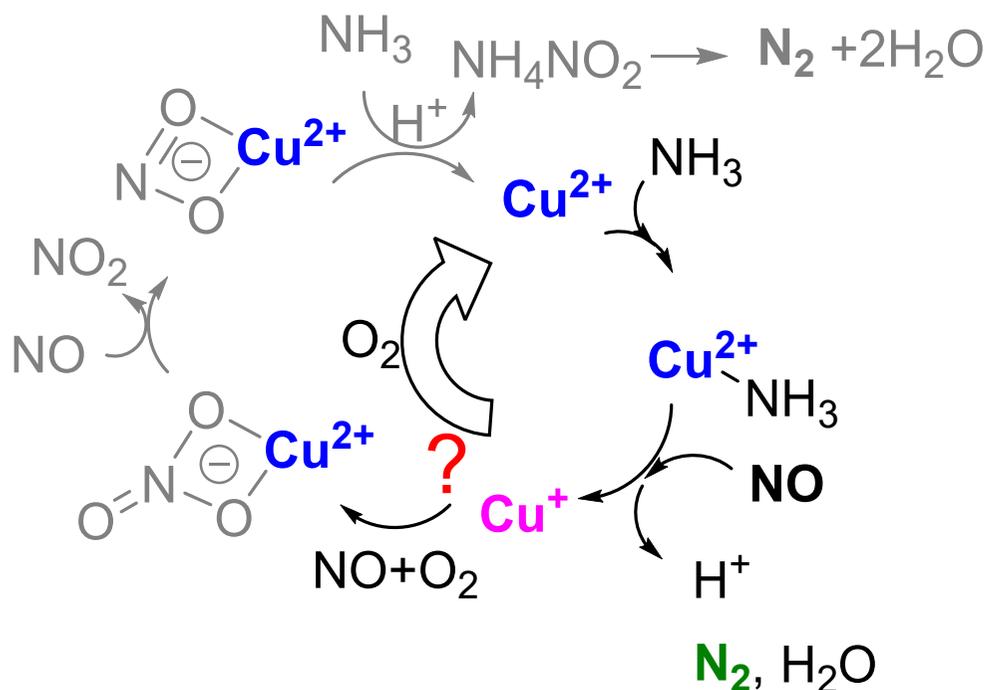
横国 窪田好浩先生

既知

1. 活性サイトはCu²⁺/Cu⁺イオン
2. Cu²⁺ ⇌ Cu⁺ redox cycleで進行

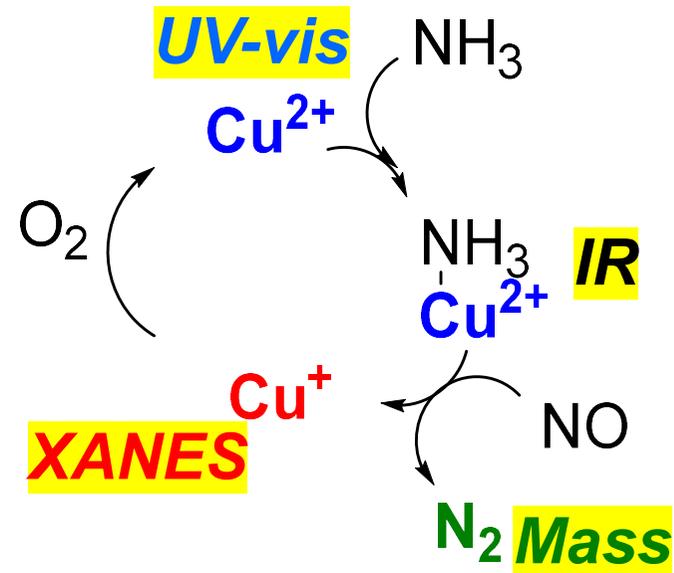
不明点

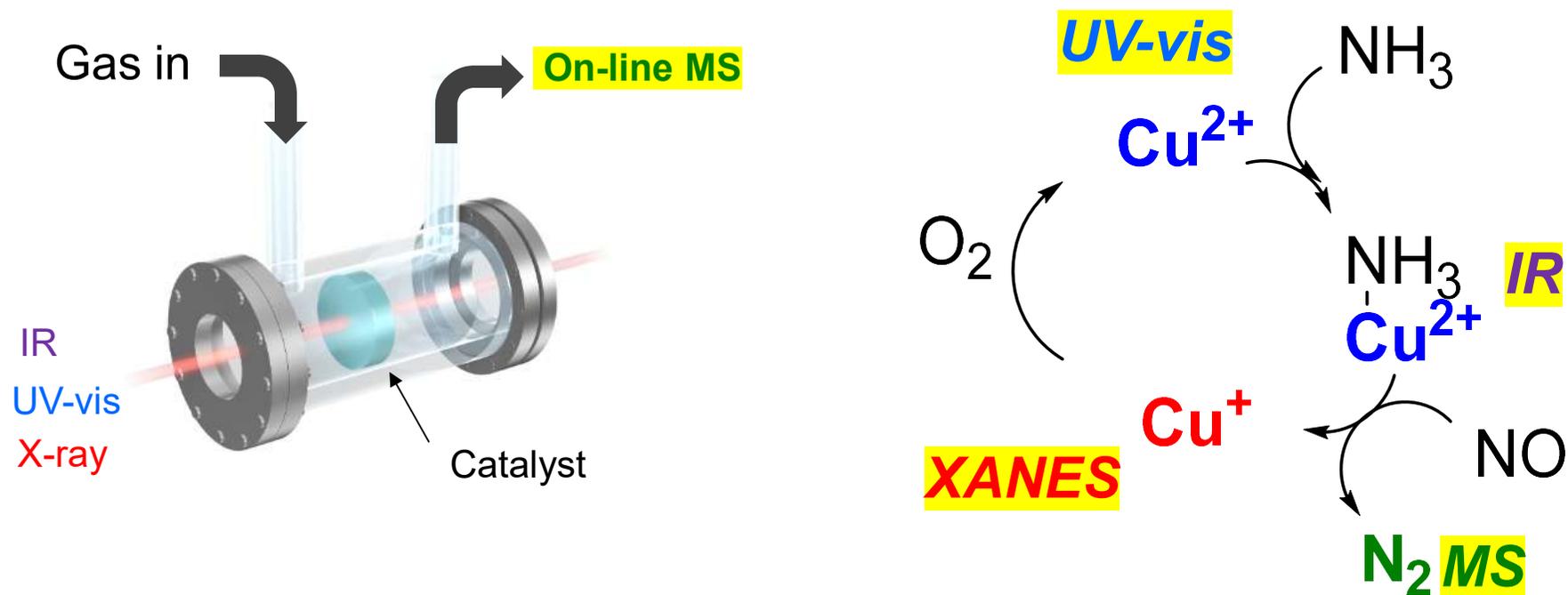
1. 素過程を直接見たのか？
2. 再酸化機構
3. NO₂, NO₃⁻, NO₂⁻, NH₄⁺の役割



Beato, *ACS Catal.* 2015, 5, 2835; Schneider, *J. Am. Chem. Soc.* 2016, 138, 6041; Schneider, *Science* 2017, 357, 898

分光・速度論・計算化学でSCR機構を決定



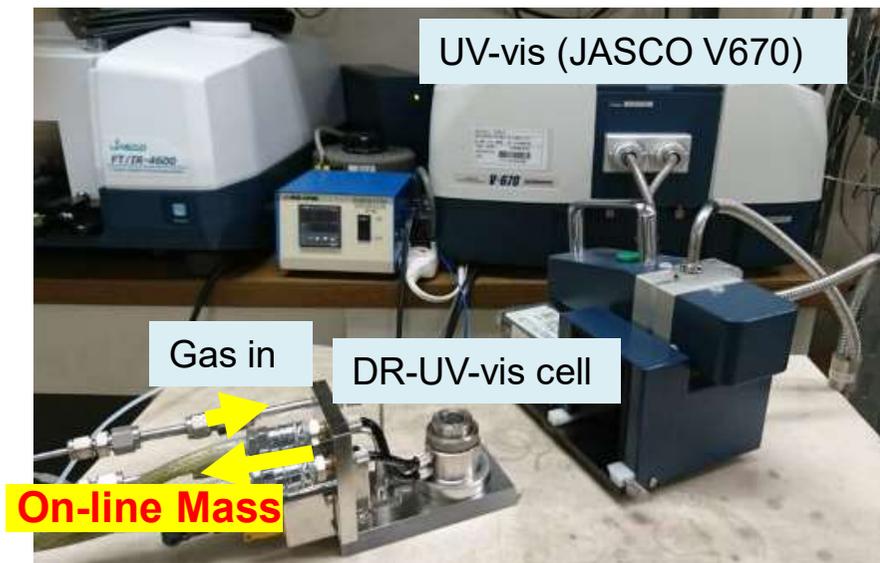


- **XANES**: 反応中の各酸化数のCuの割合を測定
- **UV**(Cu^{2+} 量), **MS**(N_2)の連続測定でCuの酸化還元速度と N_2 生成速度を同時分析
- **IR**: Cu上の吸着 NH_3 量の変化を測定
- 定常・非定常(過渡)、両方の条件でのNO還元速度・ $\text{Cu}^+/\text{Cu}^{2+}$ 割合を数値化

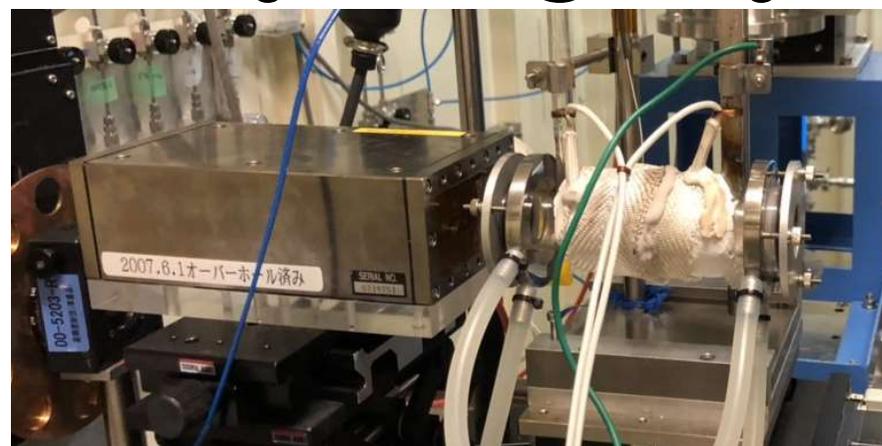
IR/Mass



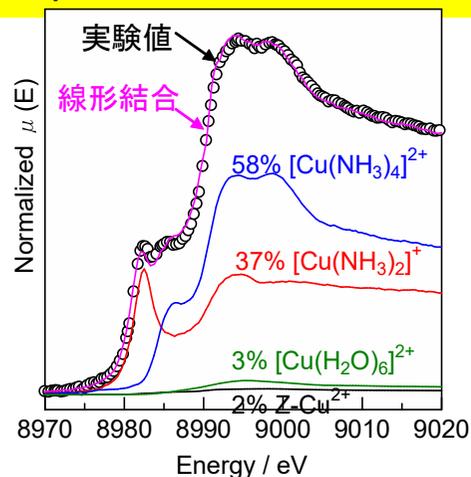
UV-vis/Mass



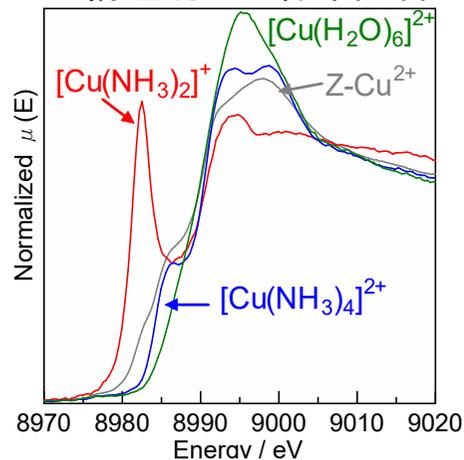
Cu K-edge XAFS @SPring-8



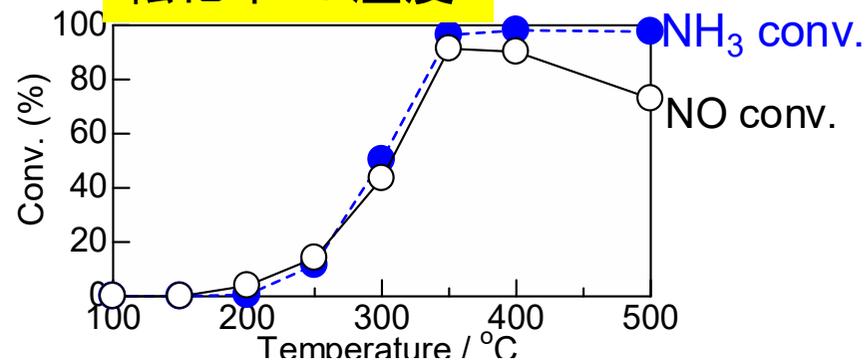
Cu⁺/Cu²⁺割合の決定方法



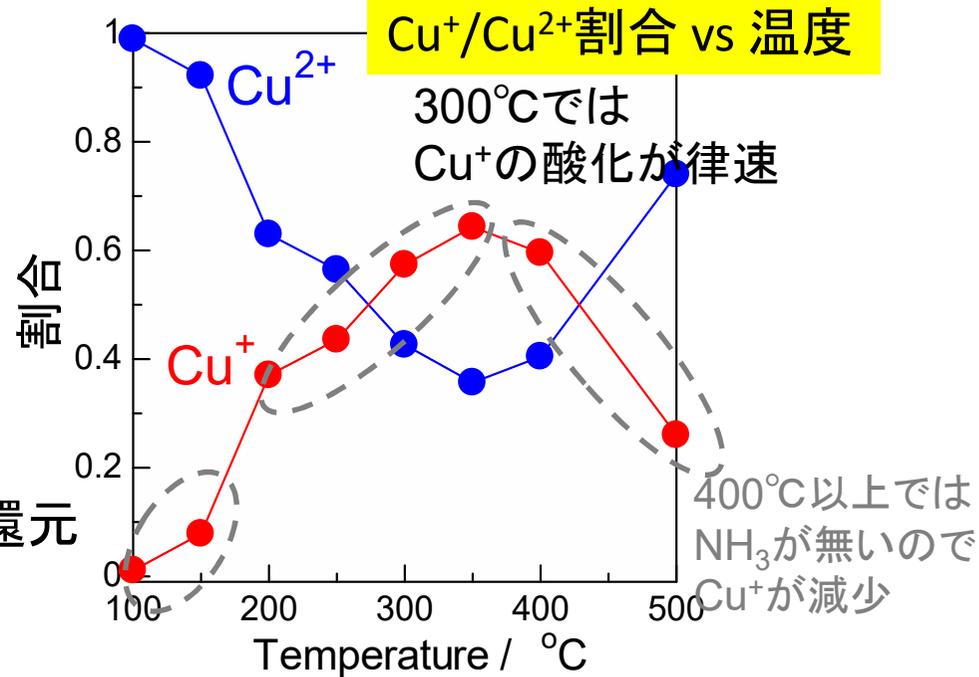
構造既知の標準試料

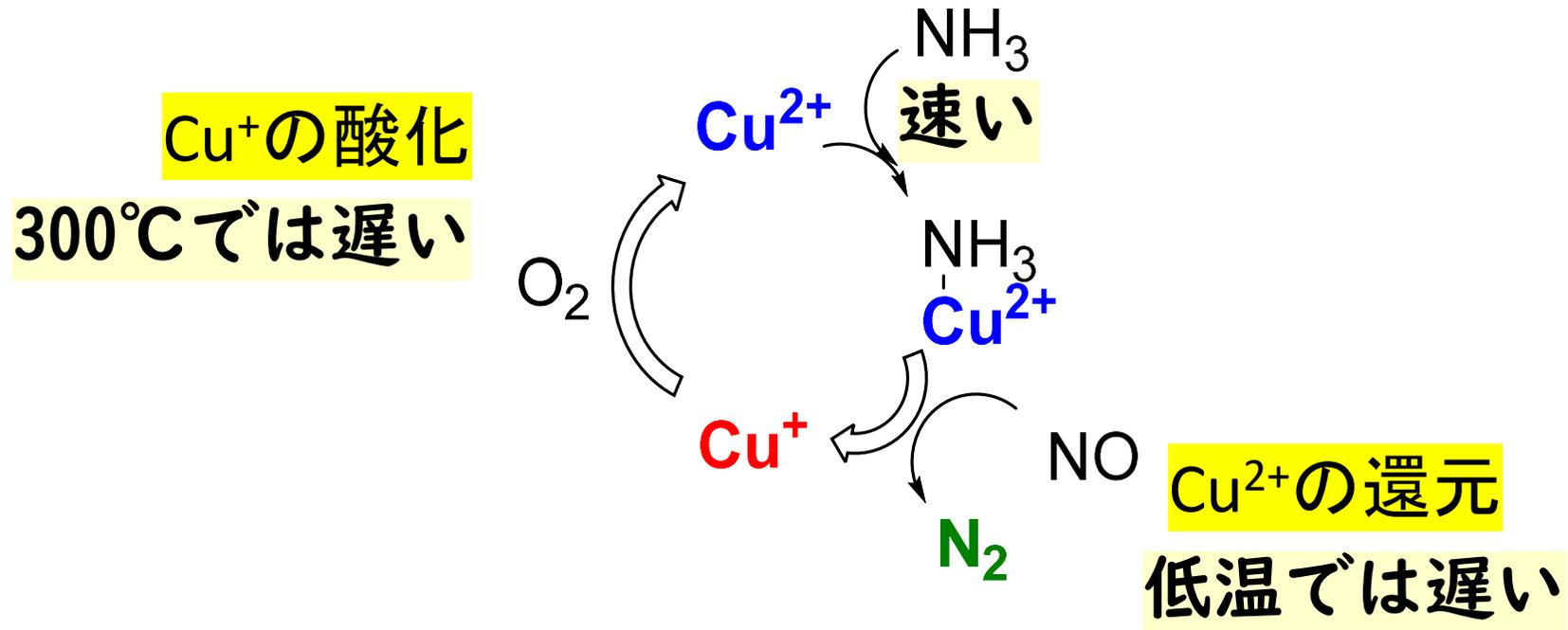


転化率 vs 温度



Cu⁺/Cu²⁺割合 vs 温度

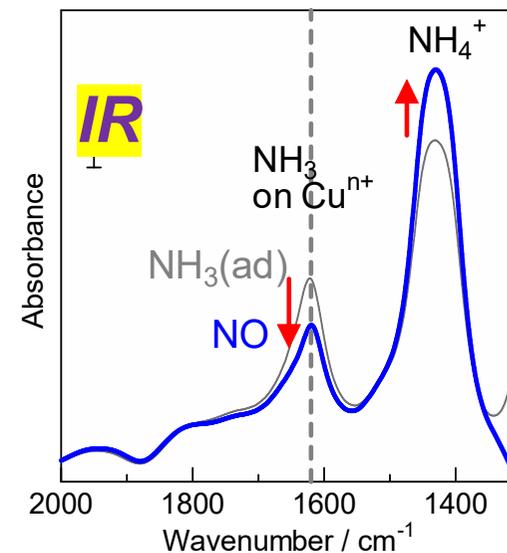
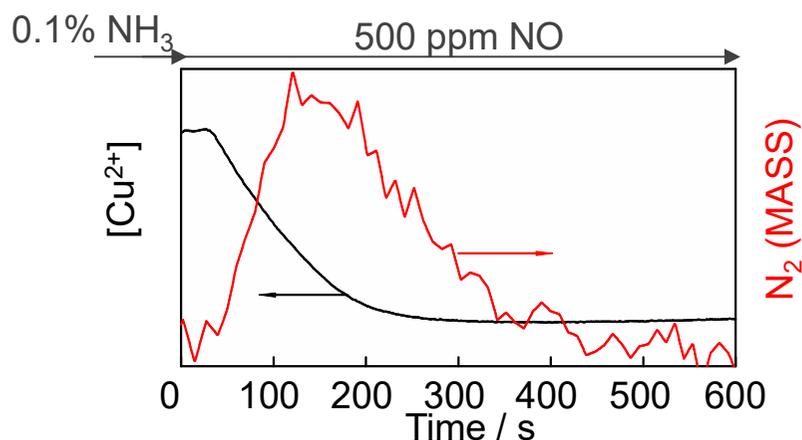




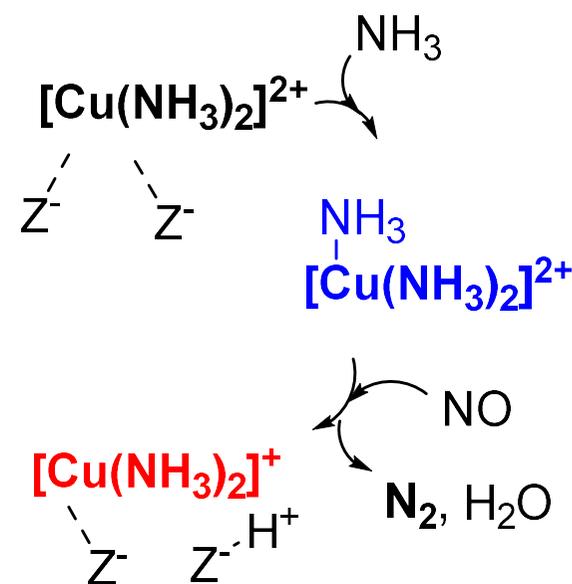
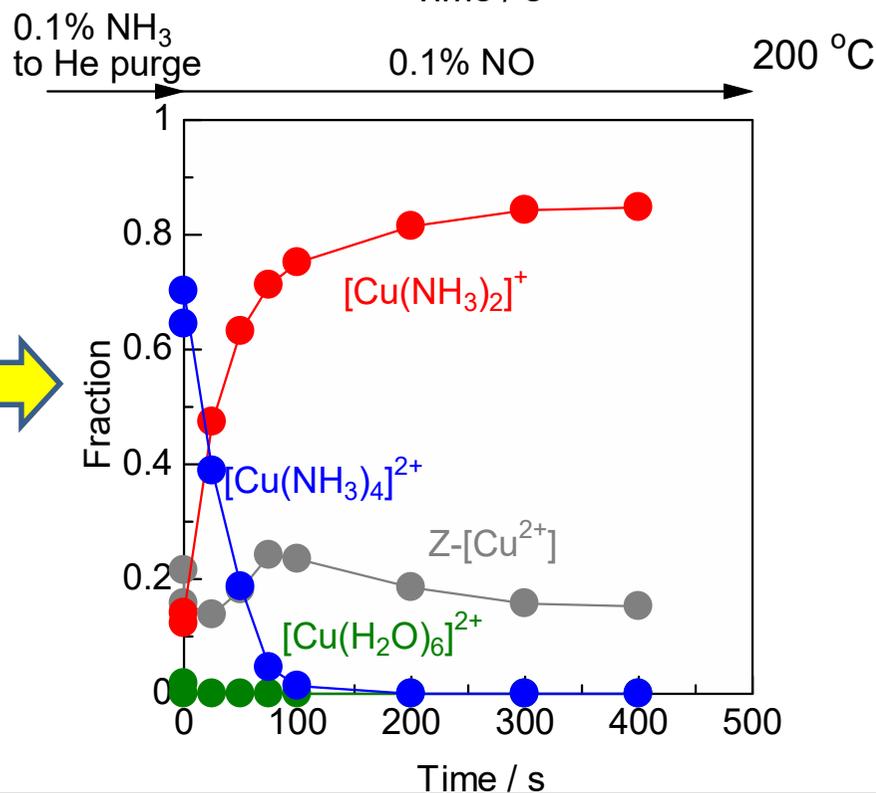
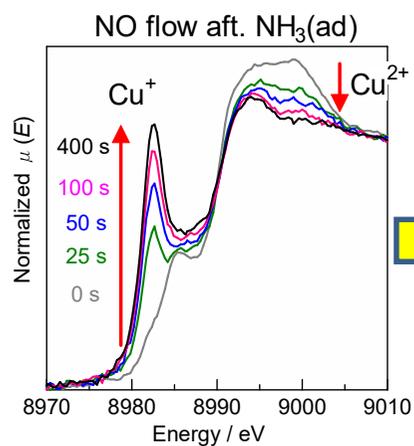
SCR中、定常状態ではこの平衡状態をみることになるので、
メカニズム明確化のためCuの還元過程、再酸化過程を分けて解析

還元素過程: $\text{Cu}^{2+}\text{-NH}_3 + \text{NO} \rightarrow \text{Cu}^+ + \text{H}^+ + \text{N}_2 + \text{H}_2\text{O}$

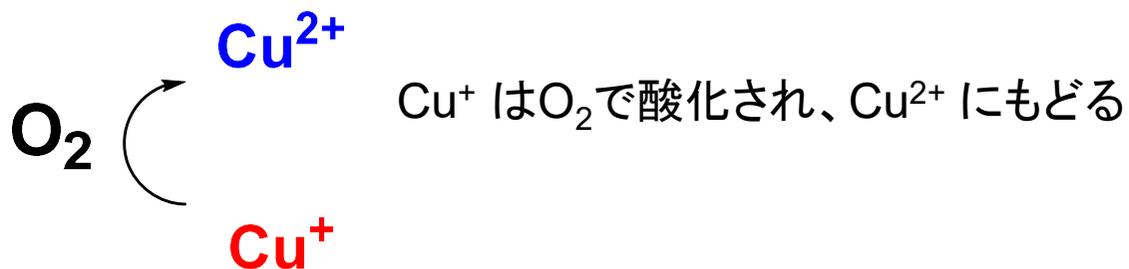
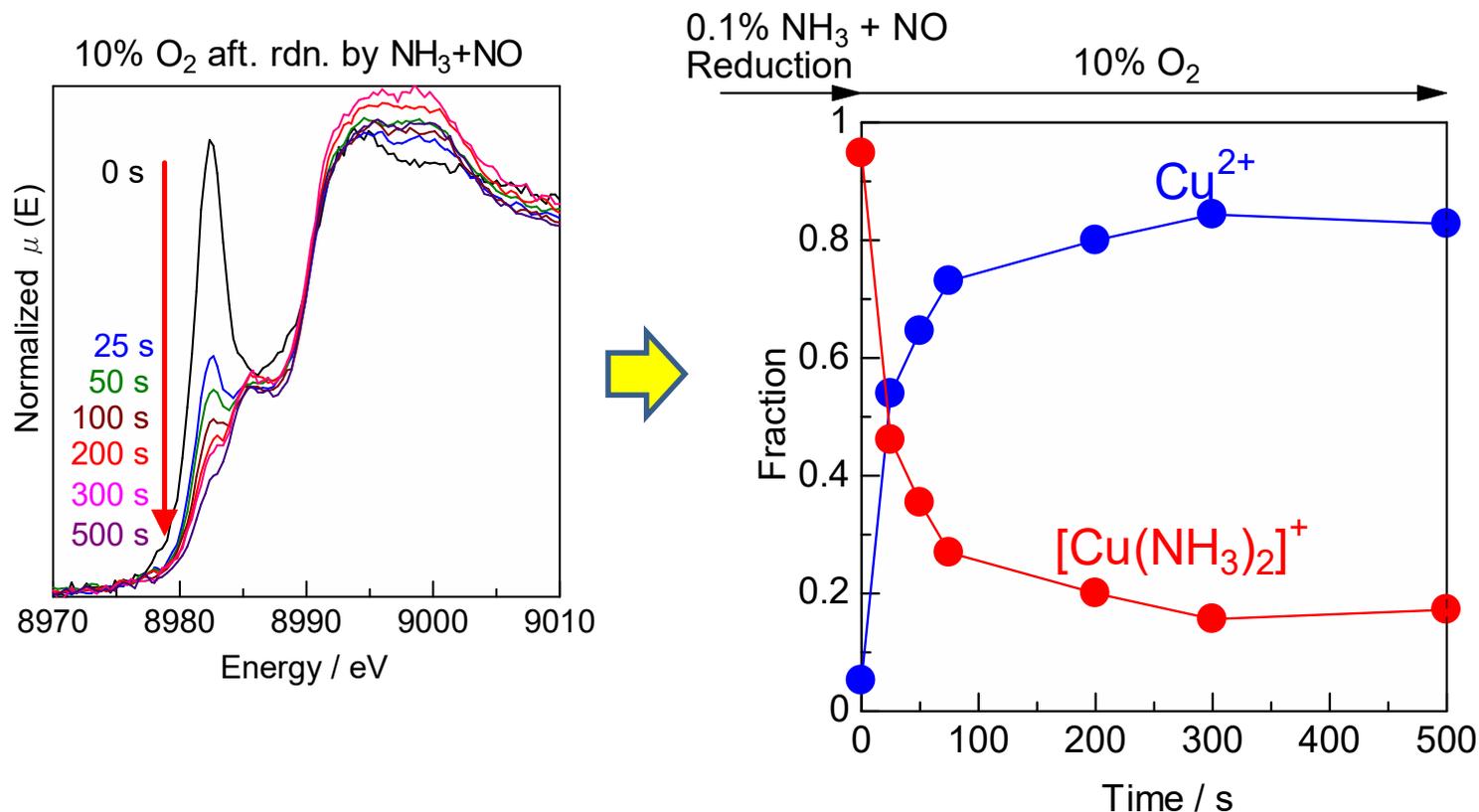
**UV-vis
& MS**

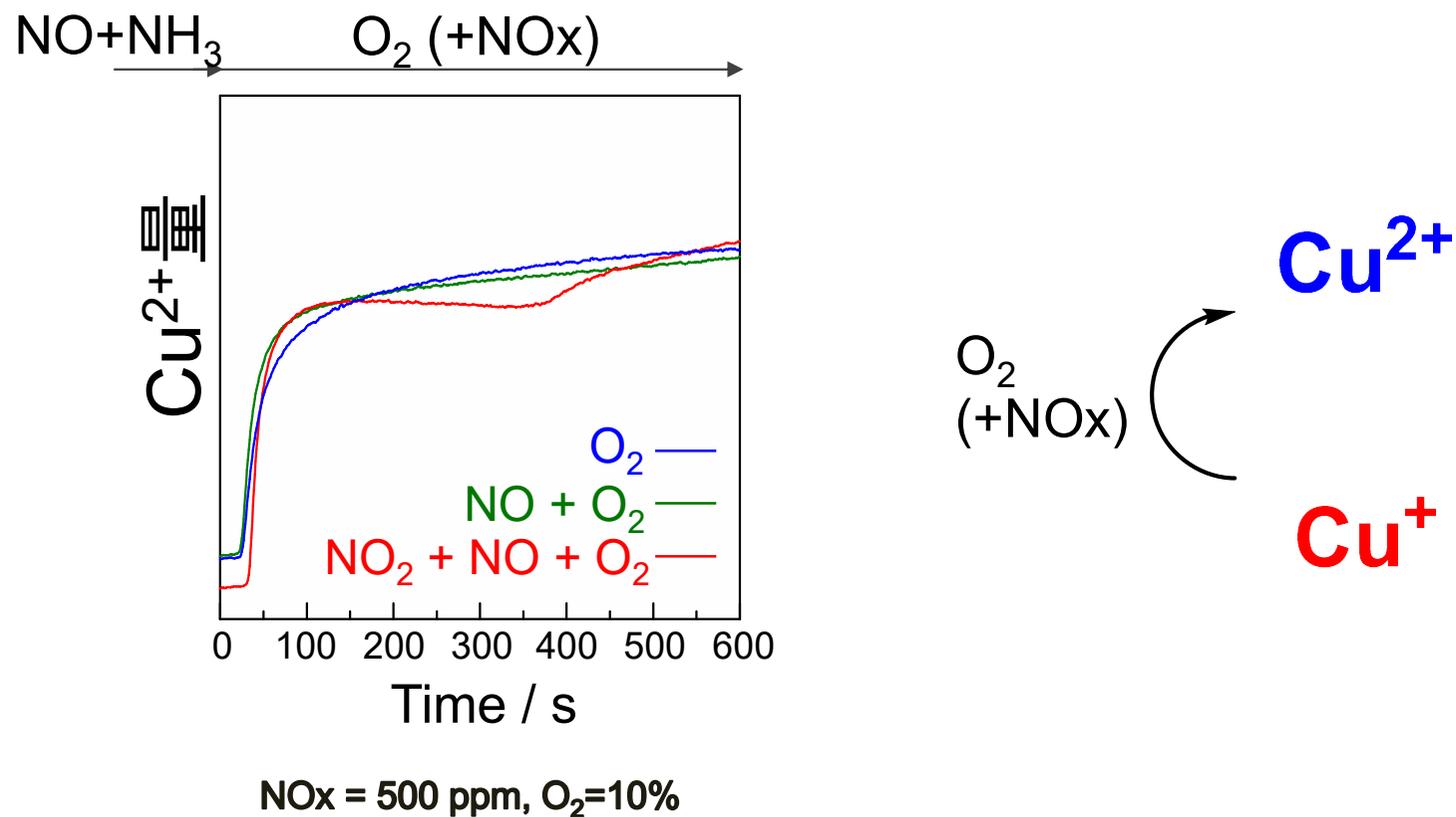


XANES

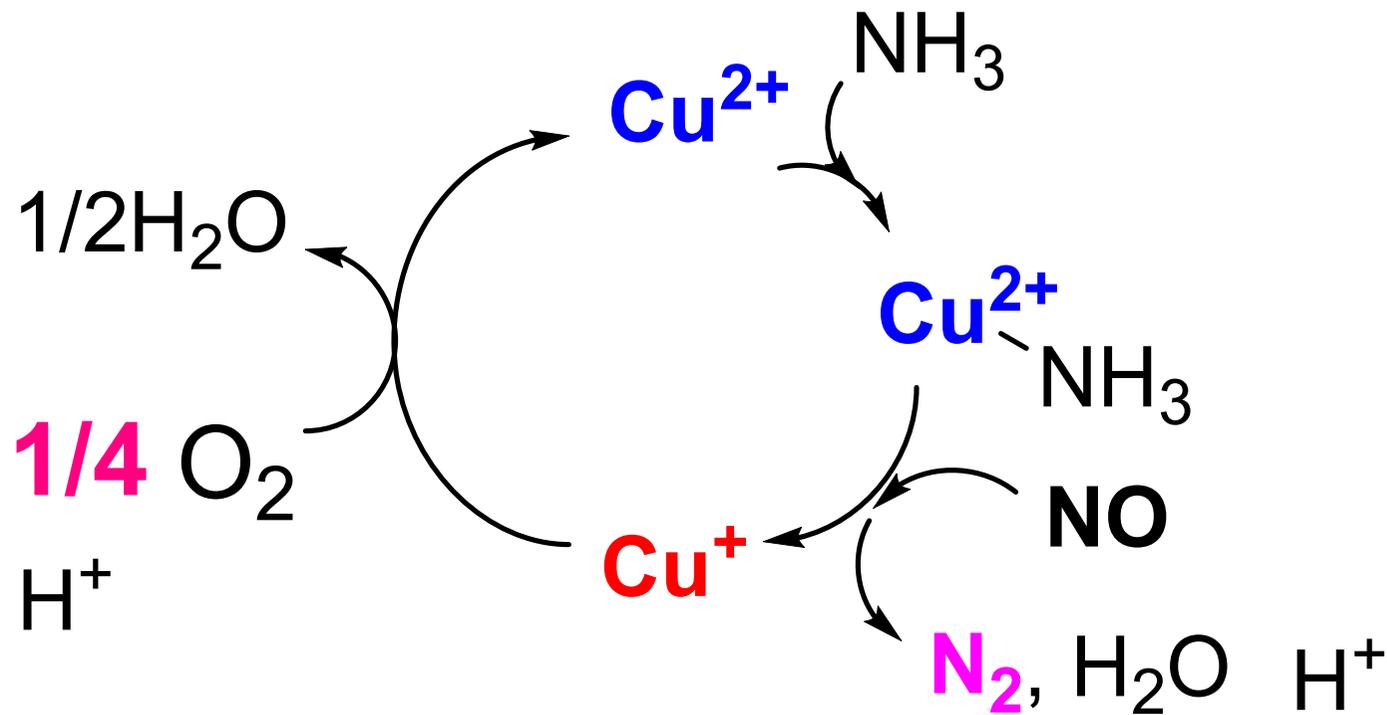


酸化過程: $\text{Cu}^+ + 1/4\text{O}_2 + \text{H}^+ \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 1/2\text{H}_2\text{O}$





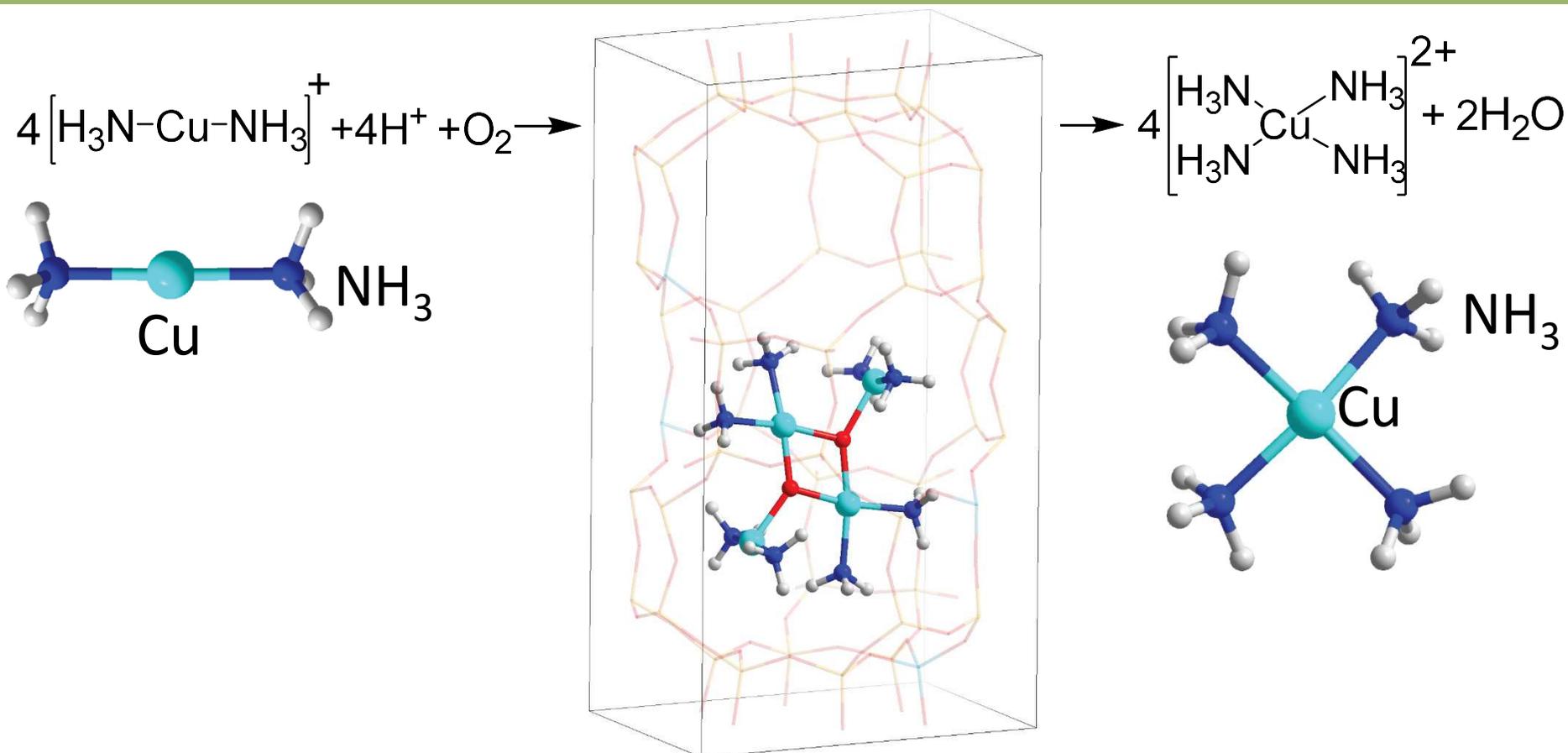
NO、NO₂ はCu⁺の酸化を促進しない！！



Cu-CHA, Cu-ZSM-5でも同じ機構です
Fe-zeoliteの機構は違う(注意！)

4個のCu⁺ とH⁺を 1個のO₂で酸化するには？

31

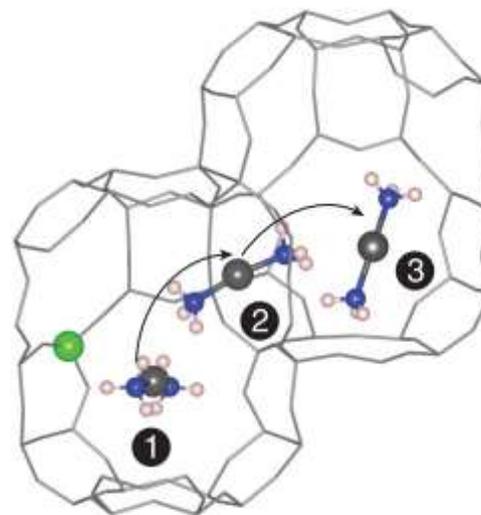
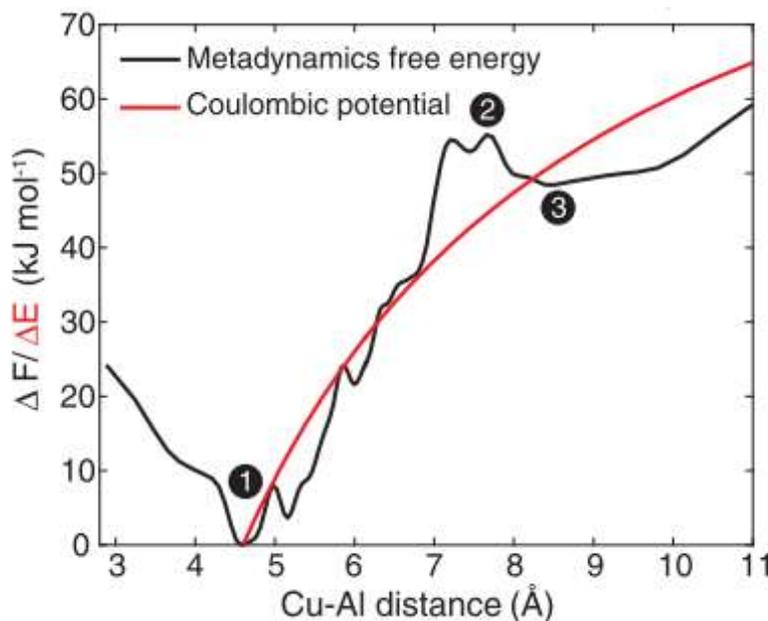


Aft cage中のAl(cu)は4個より少ないが . . .

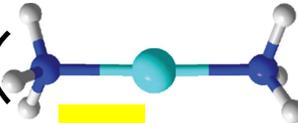
- AFX unit cell (48T, **Si/Al = 11**)
- Periodic DFT by VASP
(PBE+D3, ENCUT = 500 eV, Γ -point)

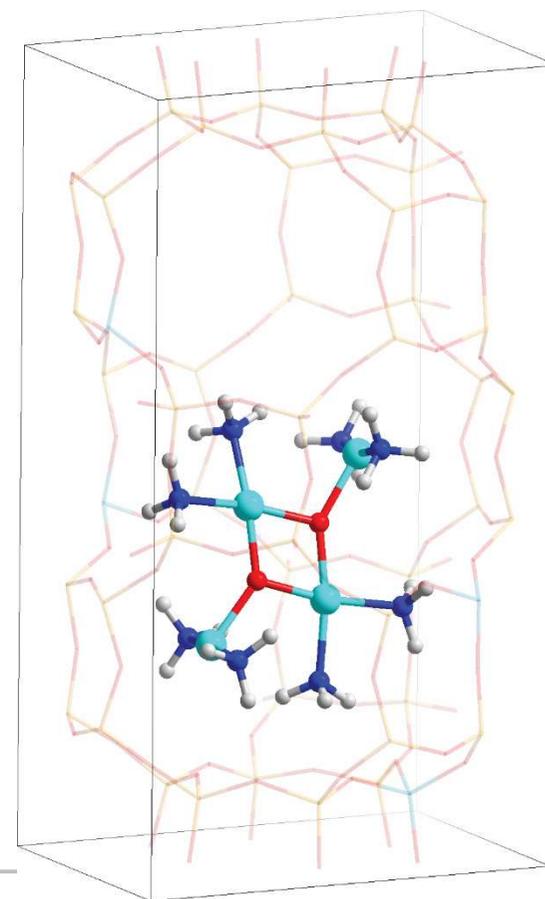
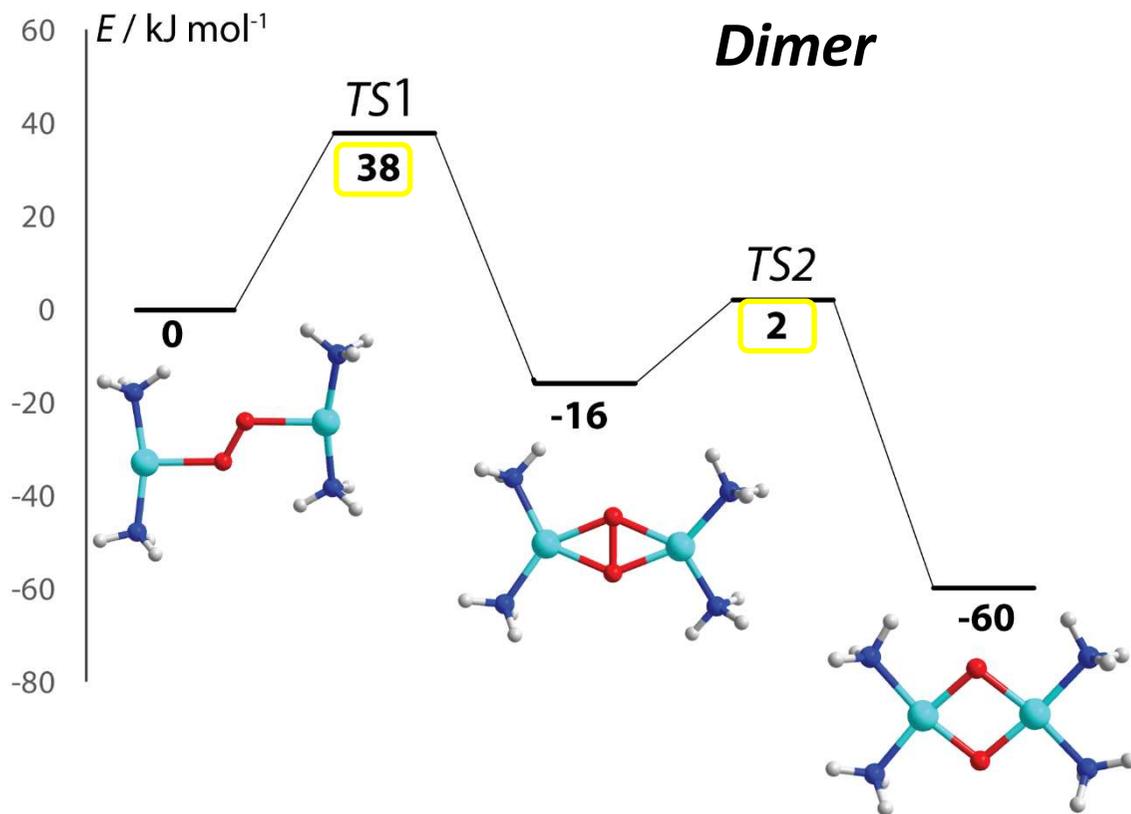
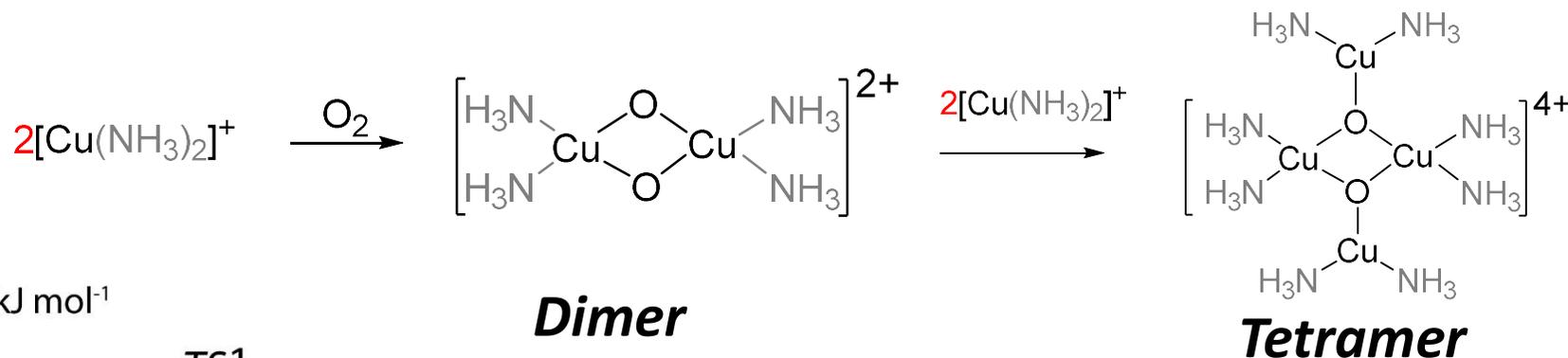
4つのCu⁺種が1つのケージに集まる！？

32



Science 357, 898, 2017

[Cu(NH₃)₂]⁺ () は8員環を通過して簡単に ($\Delta E^\ddagger = 35$ kJ/mol) 移動できる！

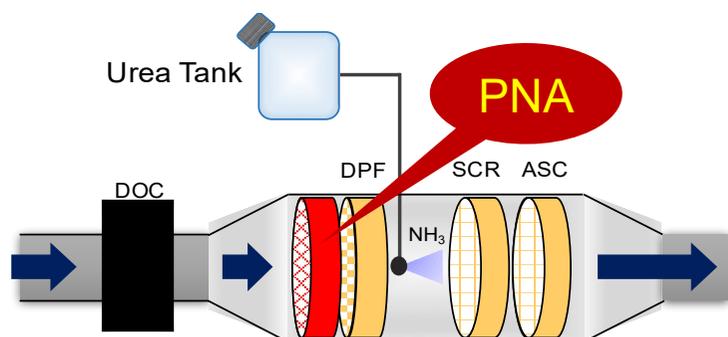


- Zeolite frameworks are omitted for clarity
- Energies in kJ mol⁻¹

リーンNO_x吸着剤 (Pd-CHA): NOによるバルクPdの原子状分散

前野禅・安村駿作

Passive NO_x adsorber (PNA)



- ❖ 低温域 (< 200 °C) でNO吸着
- ❖ 高温域 (> 300 °C) でNO脱離

尿素SCRよりも上流に設置することで低温域におけるNO_x排出を抑制

塩基系NO_x吸蔵材よりもSO_x被毒を受けにくい

Pd/ゼオライト

ゼオライト内Pdカチオンがリーン条件でNO吸着

K. Okumura, et al., *J. Phys. Chem. B* 2000, 104, 1050.

K. Shimizu, et al., *J. Catal.* 2000, 195, 151.

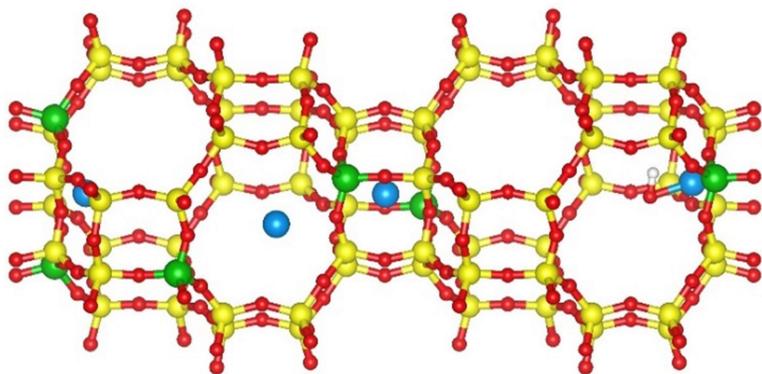
2015年からPd系PNAが流行ってる

Y. Murata, et al., *SAE Int. J. Fuels Lubr.* 2015, 8, 454.

D. Thompsett, et al., *Catal. Lett.* 2016, 146, 1706.

L. Jaeha, et al., *Catal. Sci. Tech.* 2019, 9, 163.

Pd/CHA: 水熱安定性の高いPNA材



Pore size 3.8×3.8 (Å)

問題点

液相イオン交換法では導入が困難
(水和Pdカチオンが大きいから?)

J. Szanyi, *et al.*, *J. Phys. Chem. C* 2017, 121, 15793.

D. H. Kim, *et al.*, *Cat. Today* 2019, 320, 175.

発見!

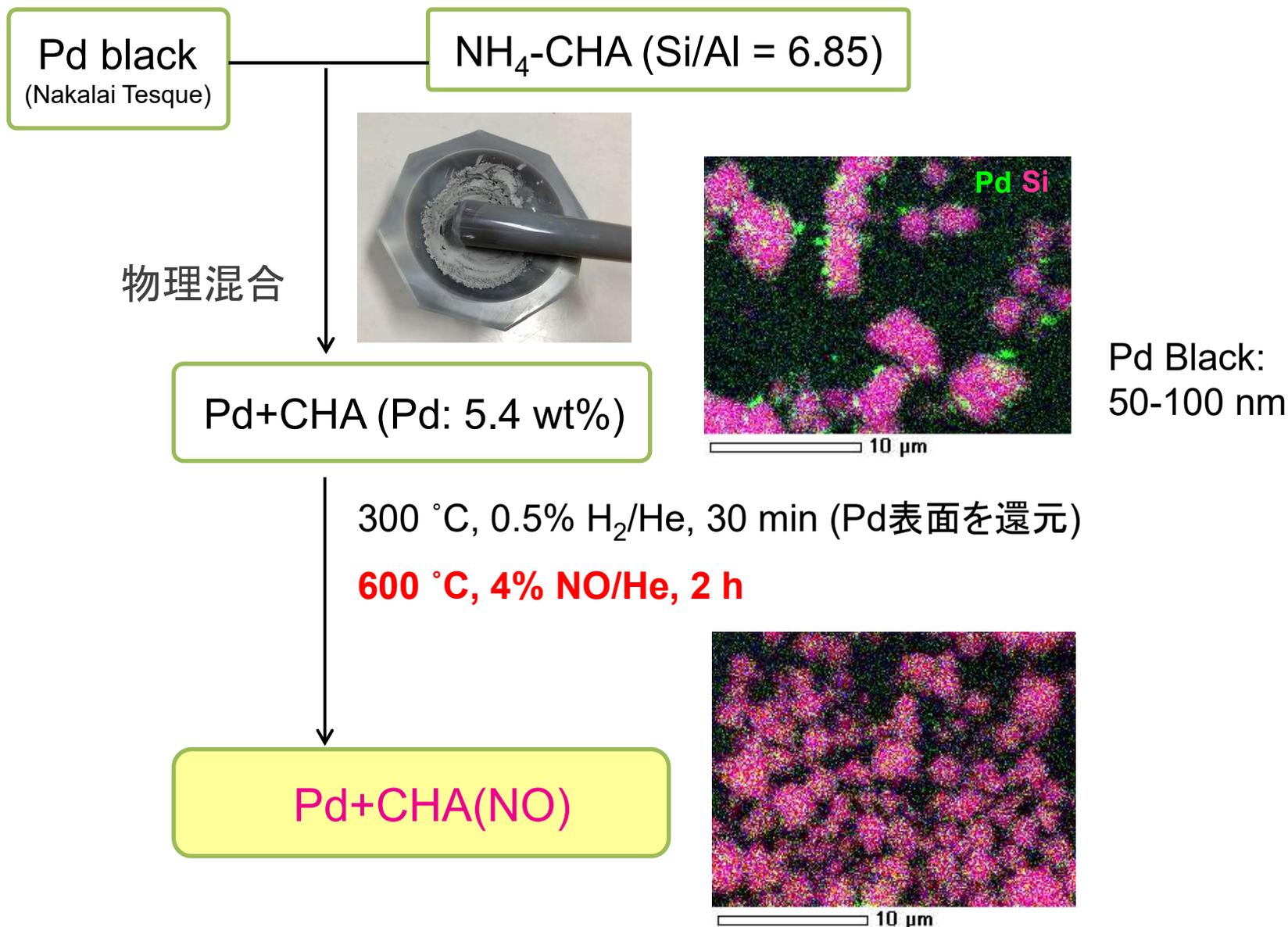
Pd金属粒子/HCHA混合物を600°CでNO処理すると、原子状Pdが細孔内に生成!

従来の湿式法よりも高いPdイオン交換率 → 高いNO吸蔵量

本研究

- ・分光法で分散化のメカニズムを解明
- ・NO吸着特性を評価

Pd black を原料にした固相イオン交換



含浸法で調製したPd/CHAでも同様

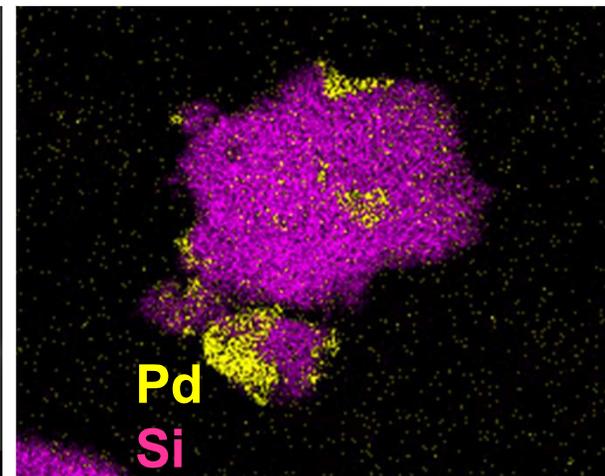
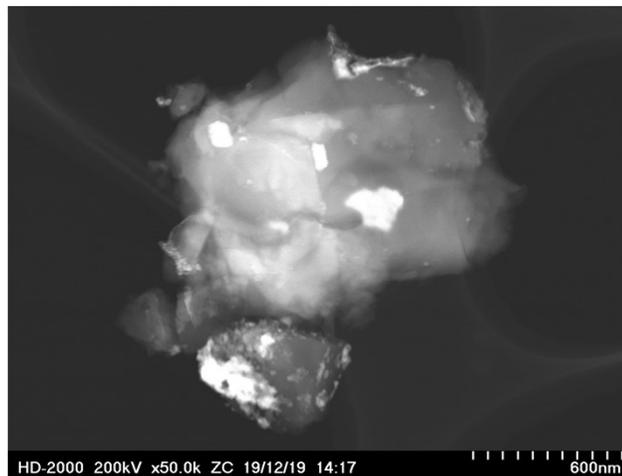
Pd_{imp}/CHA

300 °C, 0.5% H₂

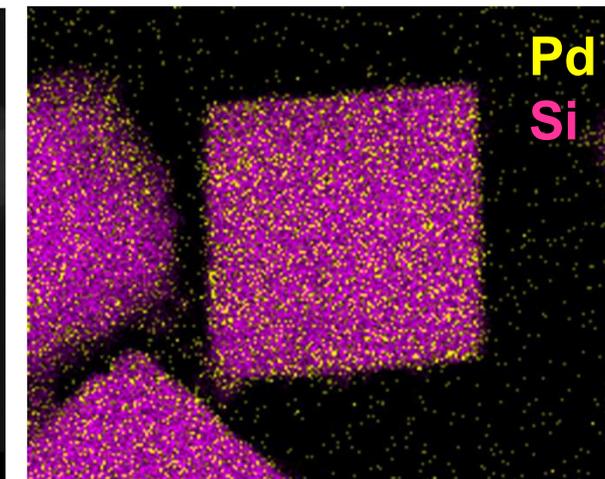
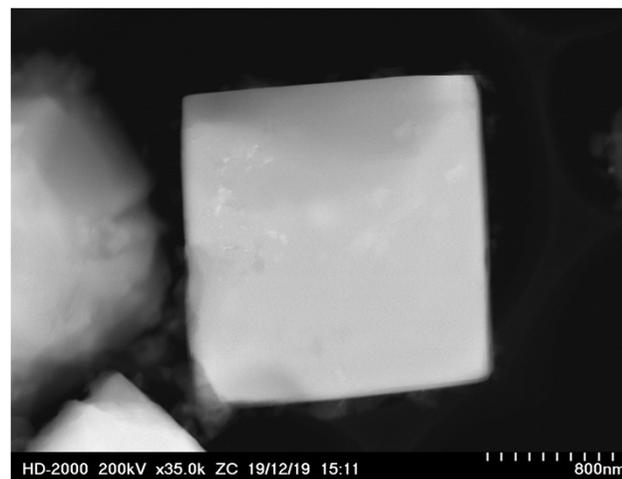
600 °C, 4% NO



Pd_{imp}/CHA(H₂_NO)



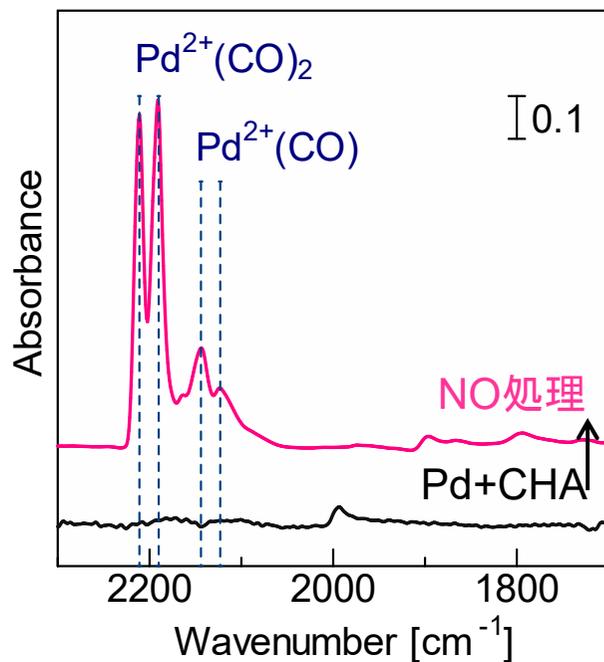
バルクPdO@外表面



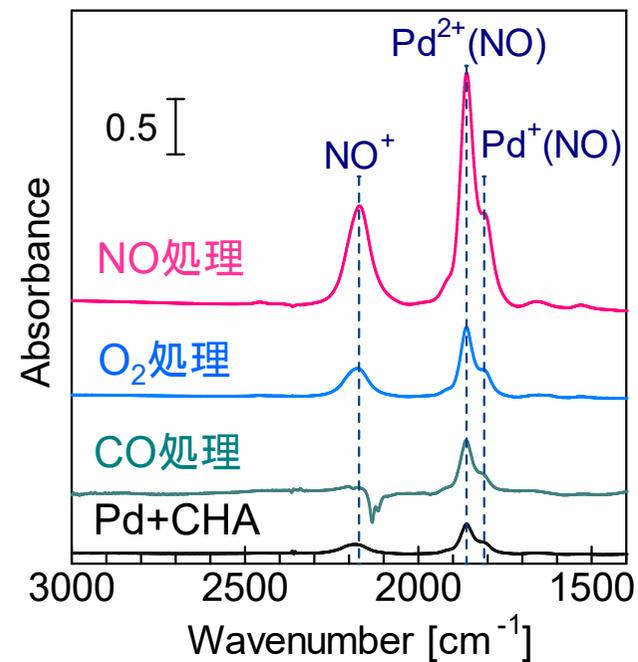
ゼオライト内にPdが分散!?

Pd²⁺上のNO, COのIR

CO-IR



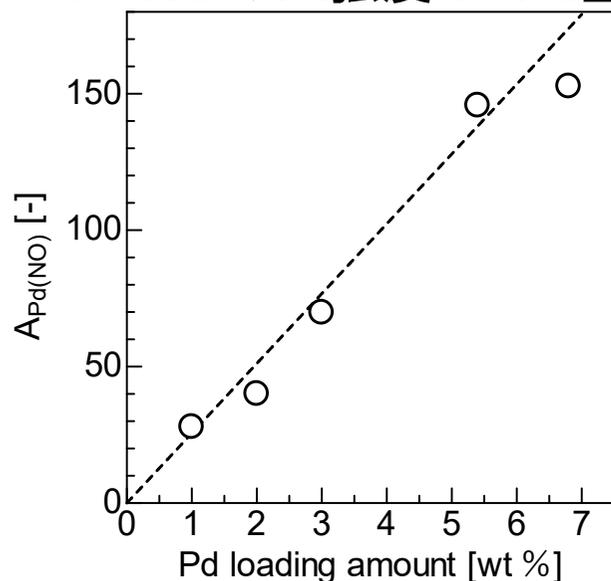
NO-IR



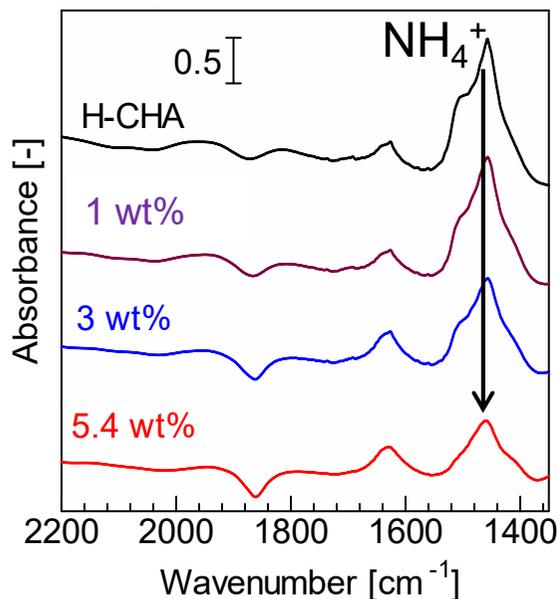
NO処理により金属Pd粒子がzeolite内のPd²⁺イオンに変化

担持量の影響

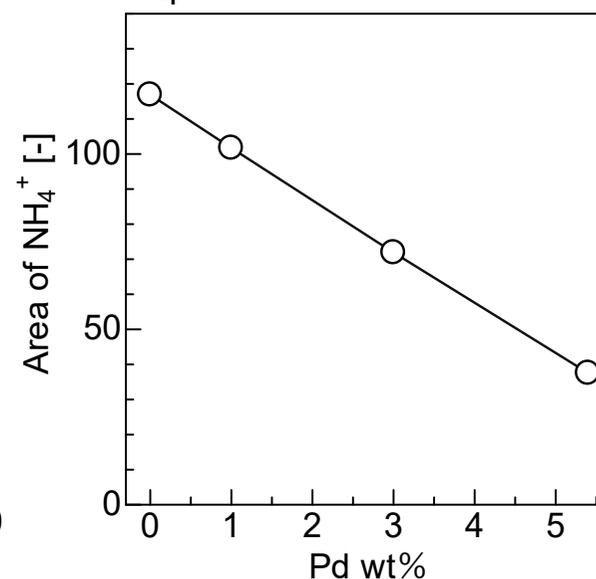
Pdⁿ⁺-NOのIR強度 vs Pd量



NH₃-IR



NH₄⁺のIR強度 vs Pd量



5.4 wt% までは、
担持量の増大に伴い、
Pdカチオン量も増大

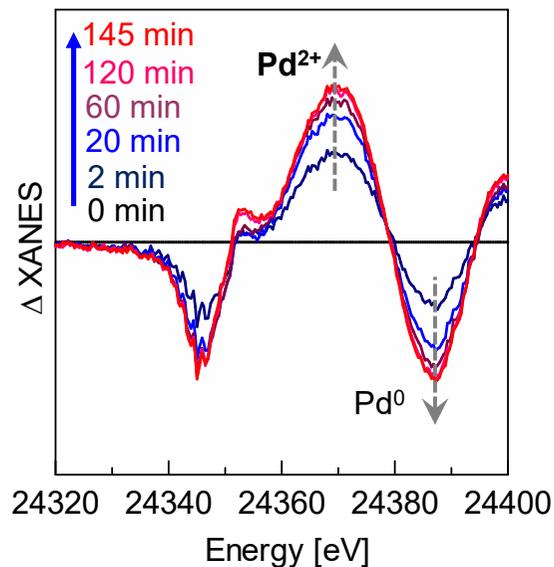
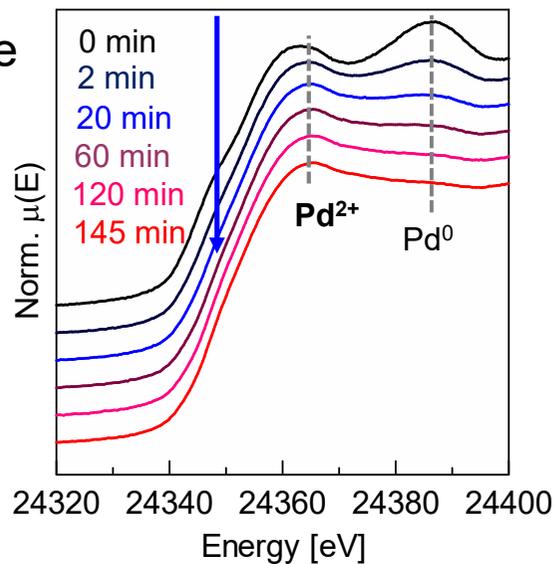
担持量の増大に伴い、Brønsted酸点が減少
→ **イオン交換サイト上にPdカチオンが固定化**

Sample	Pd担持量	NO/Pd	孤立Pd ²⁺ 量
Pd _{imp} /CHA(H ₂ _NO)	5.4 wt%	0.76	4.1 wt%
Pd+CHA(NO)	5.4 wt%	0.76	4.1 wt%
Pd/CHA	5.0 wt%	0.70	3.5 wt%

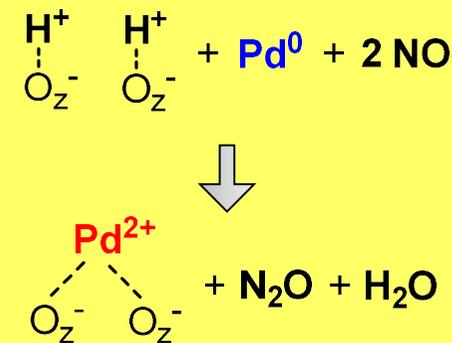
J. Szanyi, et al., *ACIE*. 2018, 57, 16672.

高分散化(600°C NO)中の構造変化

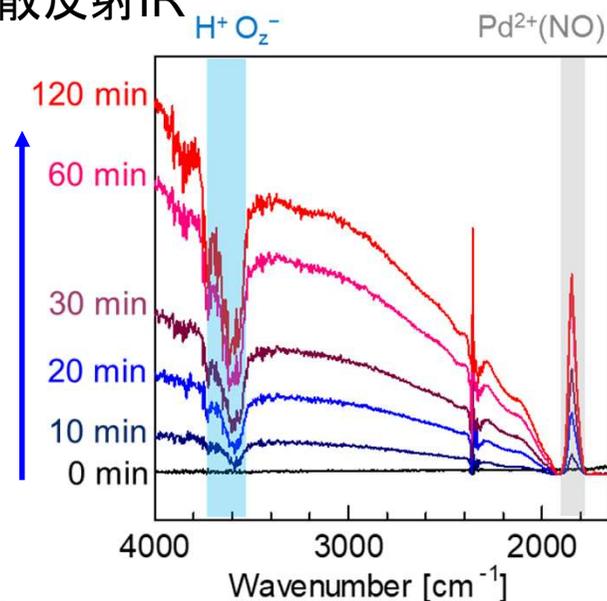
Pd K-edge XANES



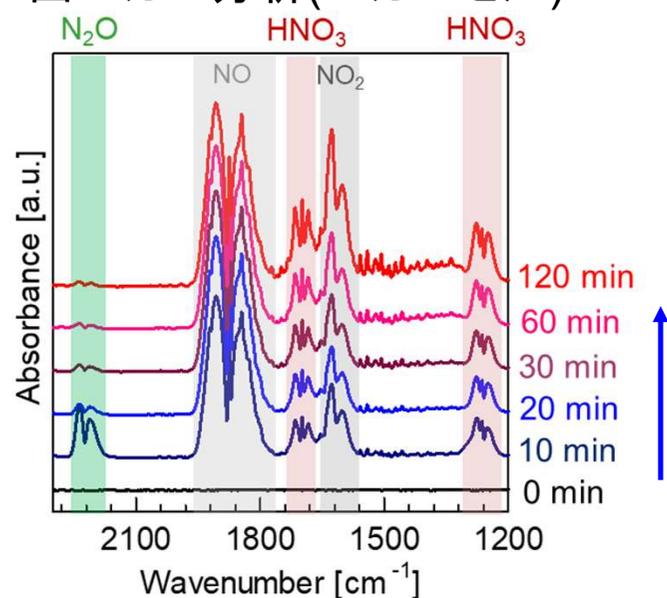
酸化的
固相イオン交換



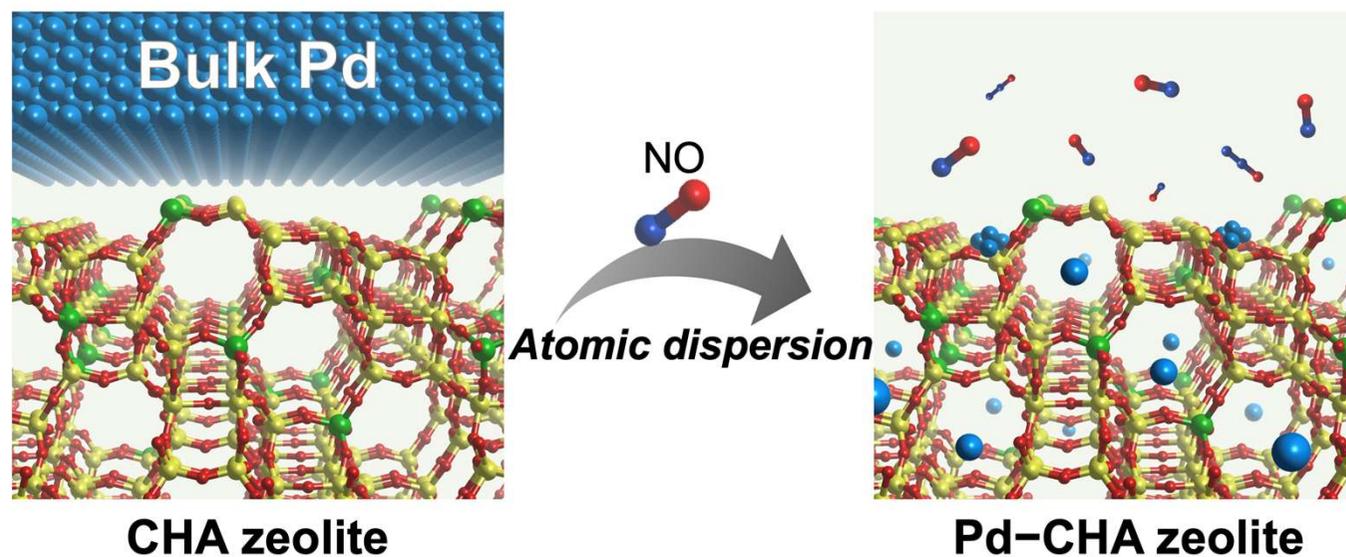
拡散反射IR



出口ガス分析(IRガスセル)



まとめ



Pd metalはNOとの反応により、ゼオライト内Pdカチオンとして分散化

Pd blackを原料にした固相イオン交換反応による調製が可能

従来よりも高い担持量(4 wt%)で、CHAゼオライト内にPdカチオンを導入

SCR用Ag/Al₂O₃ 雰囲気変動によるAgの可逆的凝集・再分散

窪田博愛, 清水研一

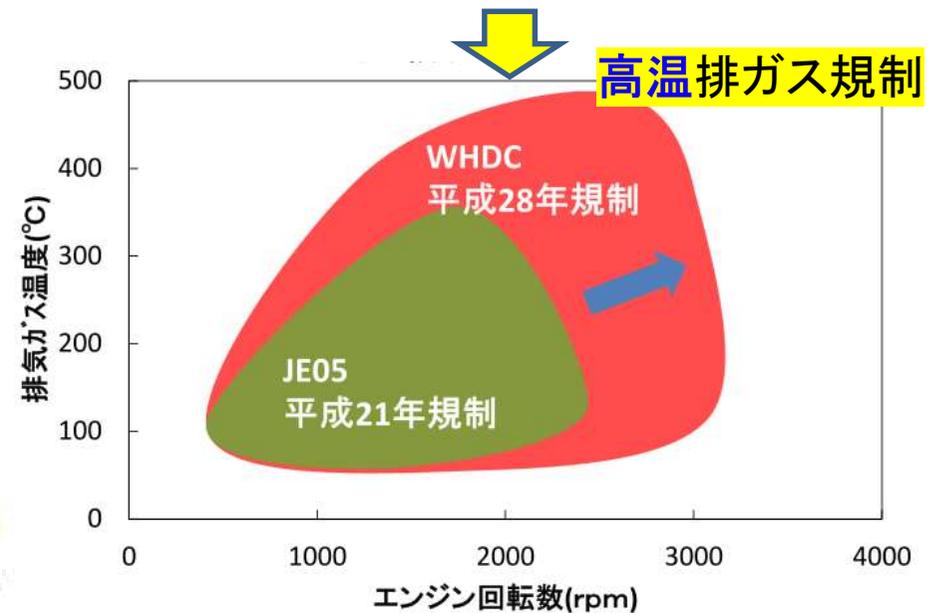
キャタラー、HC-SCRシステム

- ・日野の小型トラック「デュトロ」に搭載
- ・尿素水なしで平成28年排出ガス規制をクリア



実用化

Ag/Al₂O₃が液体HCによるNO_x還元にも有効！
但し、**高温**限定(1999, Satsuma, Shimizu)

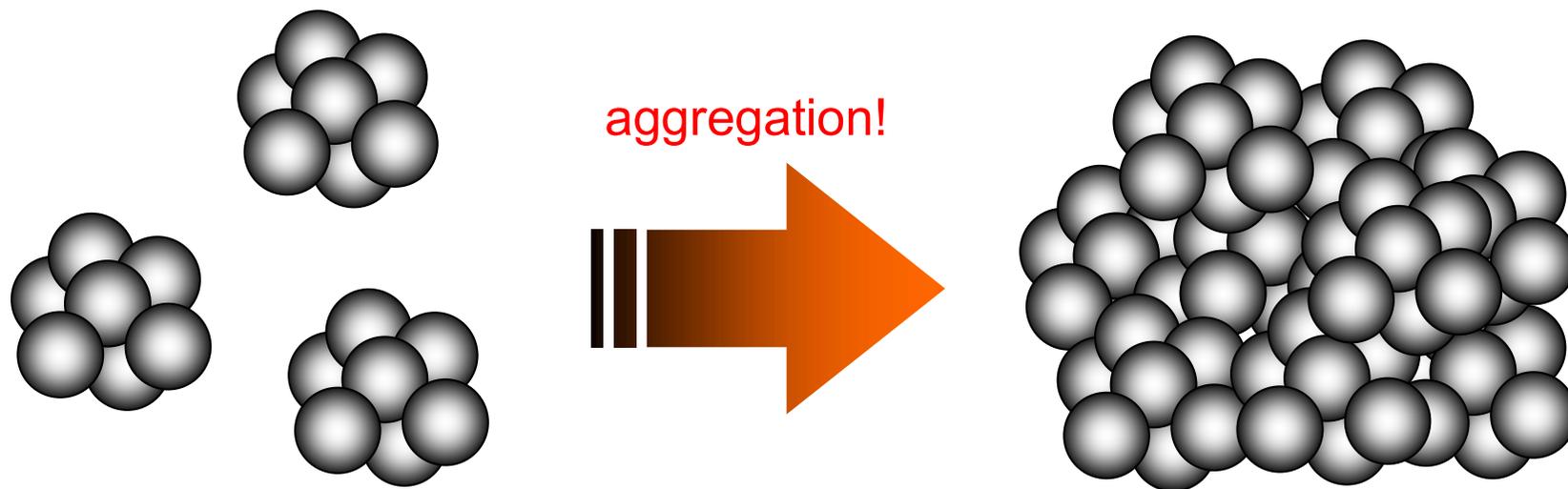


CATALER



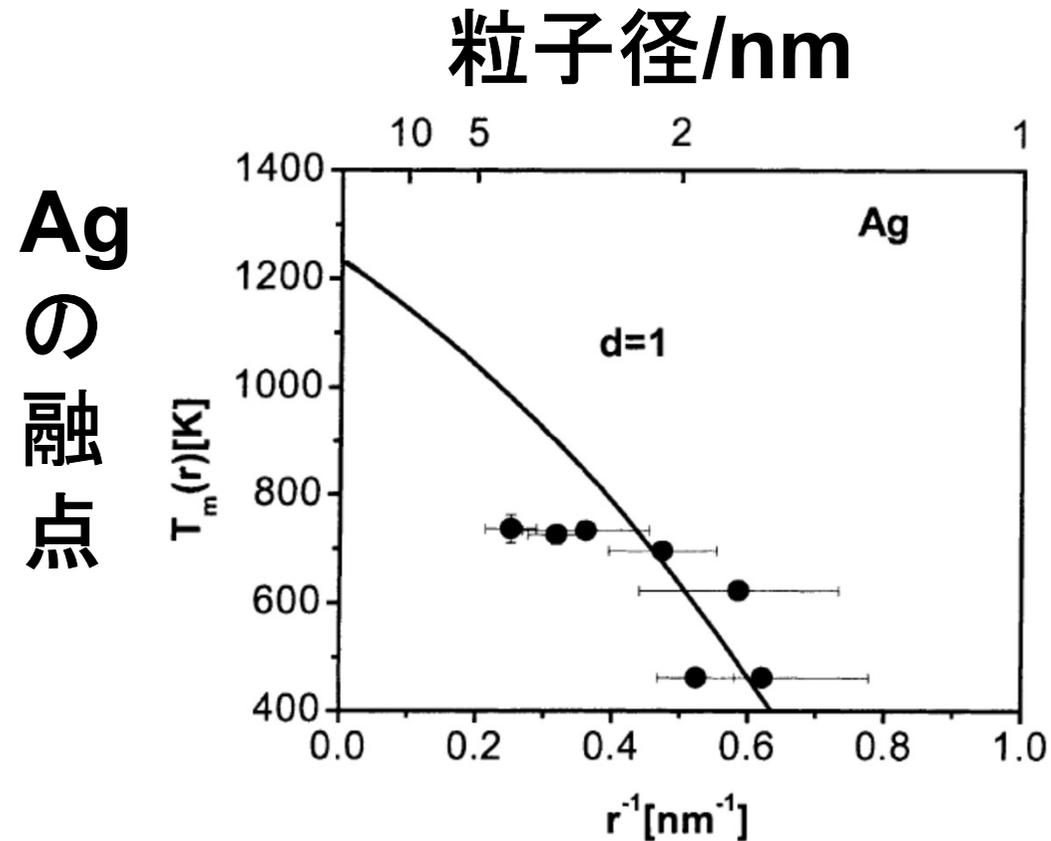
<https://www.cataler.co.jp/aee2018/diesel/hc-scr.php>

Agの融点 = 962 °C



粒子径が小さいほど、表面エネルギー大（低融点）

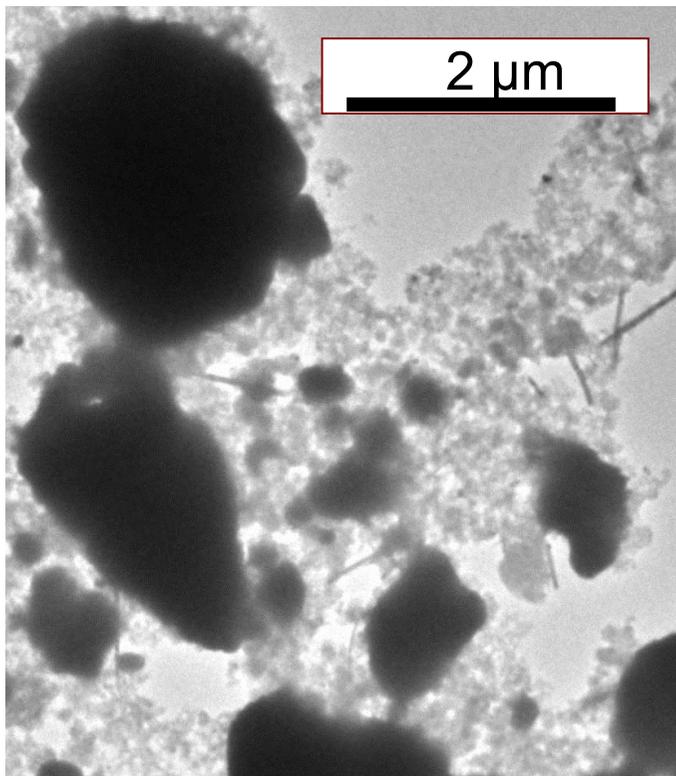
Mater. Chem. Phys. 82 (2003) 225



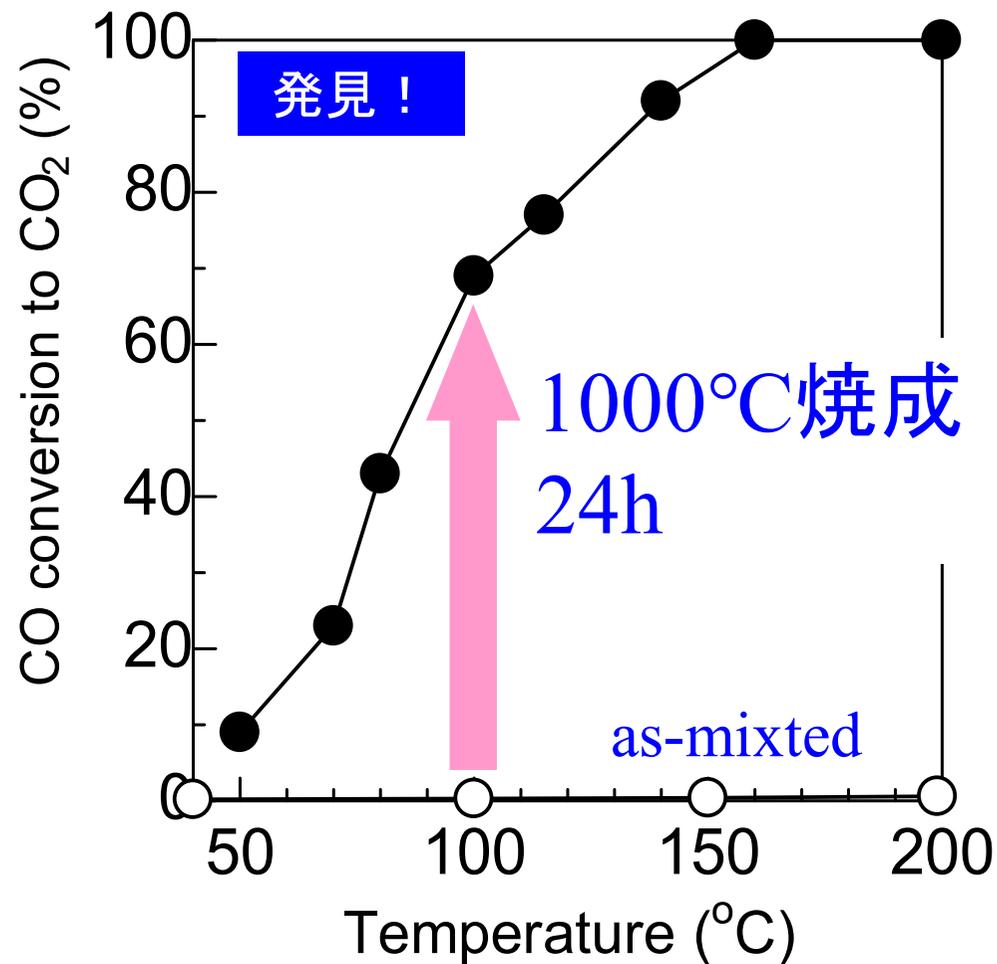
担体が無い場合、2nmのAgの融点は、400°C

【仮説】アルミナ担体がAgをアンカー？

Ag粉と $\gamma\text{Al}_2\text{O}_3$ の混合物を1000°Cで焼いてみたら・・・



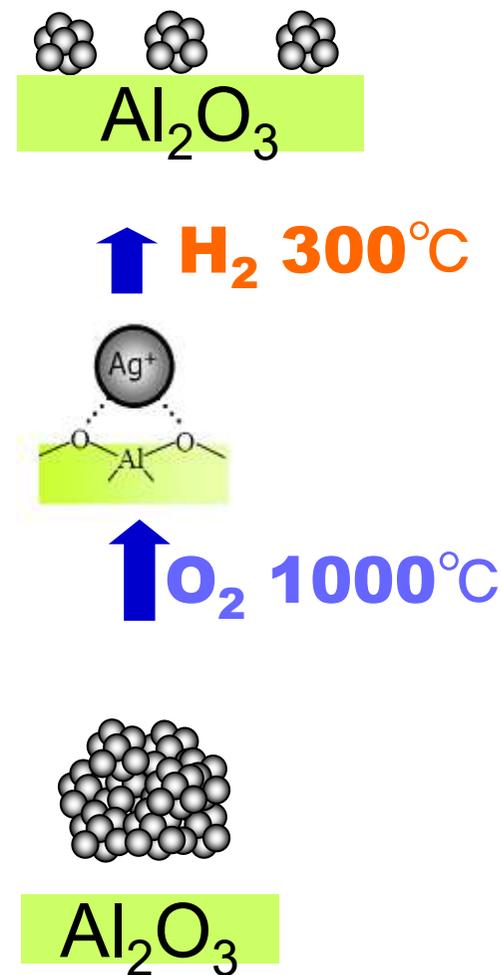
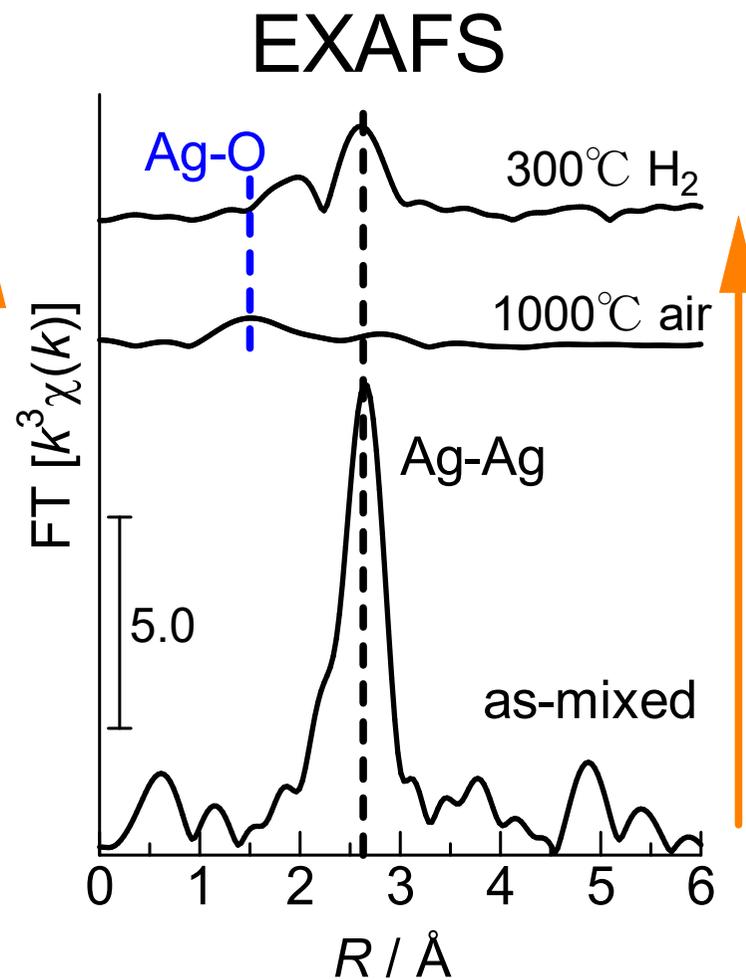
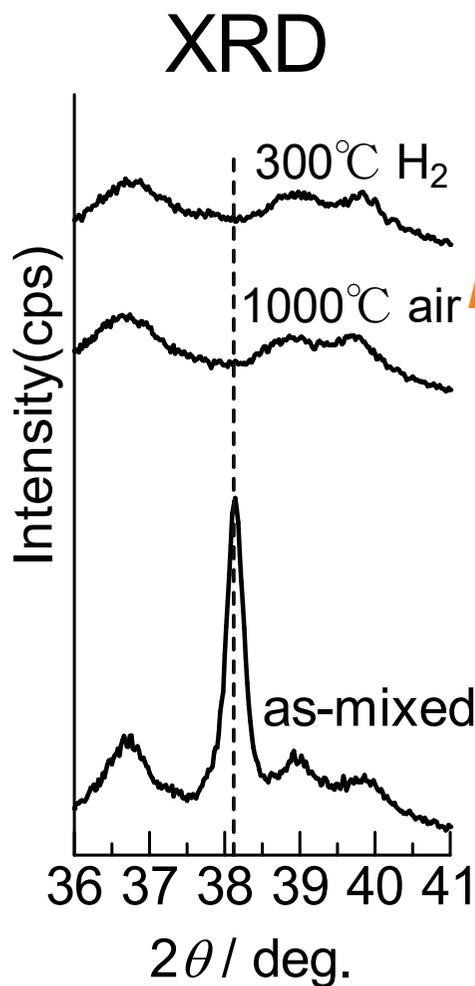
この水平幅 日付
8.5 μm 11/03/09, 19:31



CO酸化活性が発現!

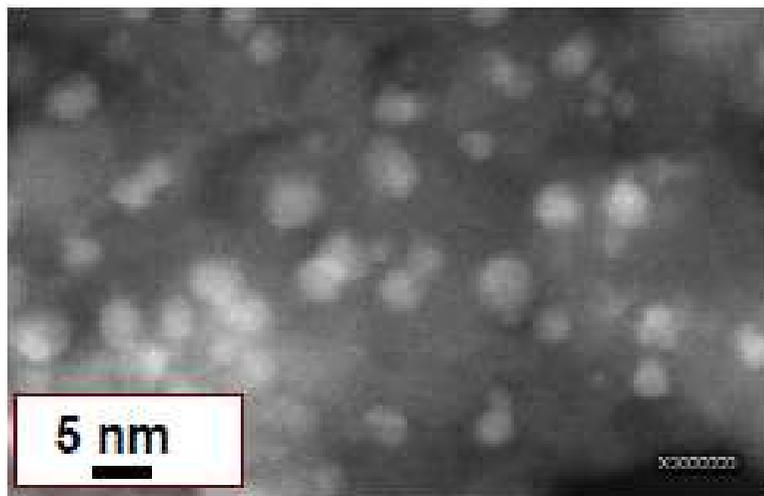
高温焼成でAgの構造が変化したはず

処理前後Agの構造をXRD, XAFSでしらべると

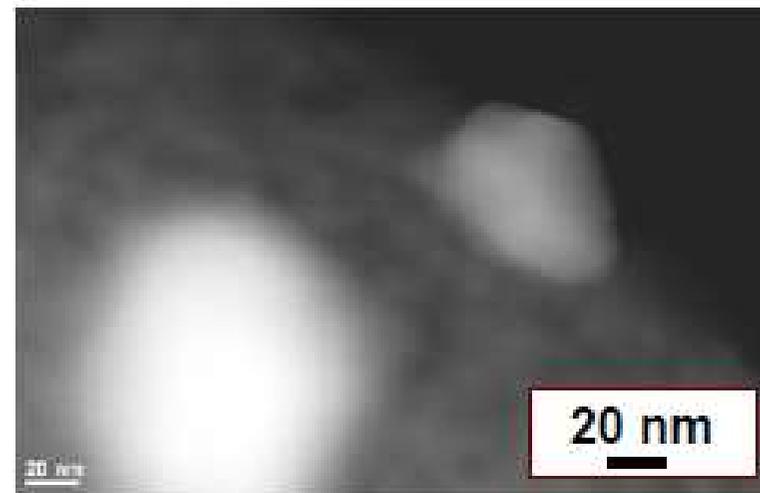


Ag粉(5wt%)とAl₂O₃
の混合物

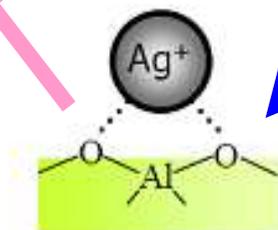
再度、シンタリングさせても、1000°C焼成で再分散



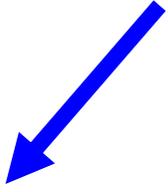
900°C
H₂



100~300°C
CO or H₂

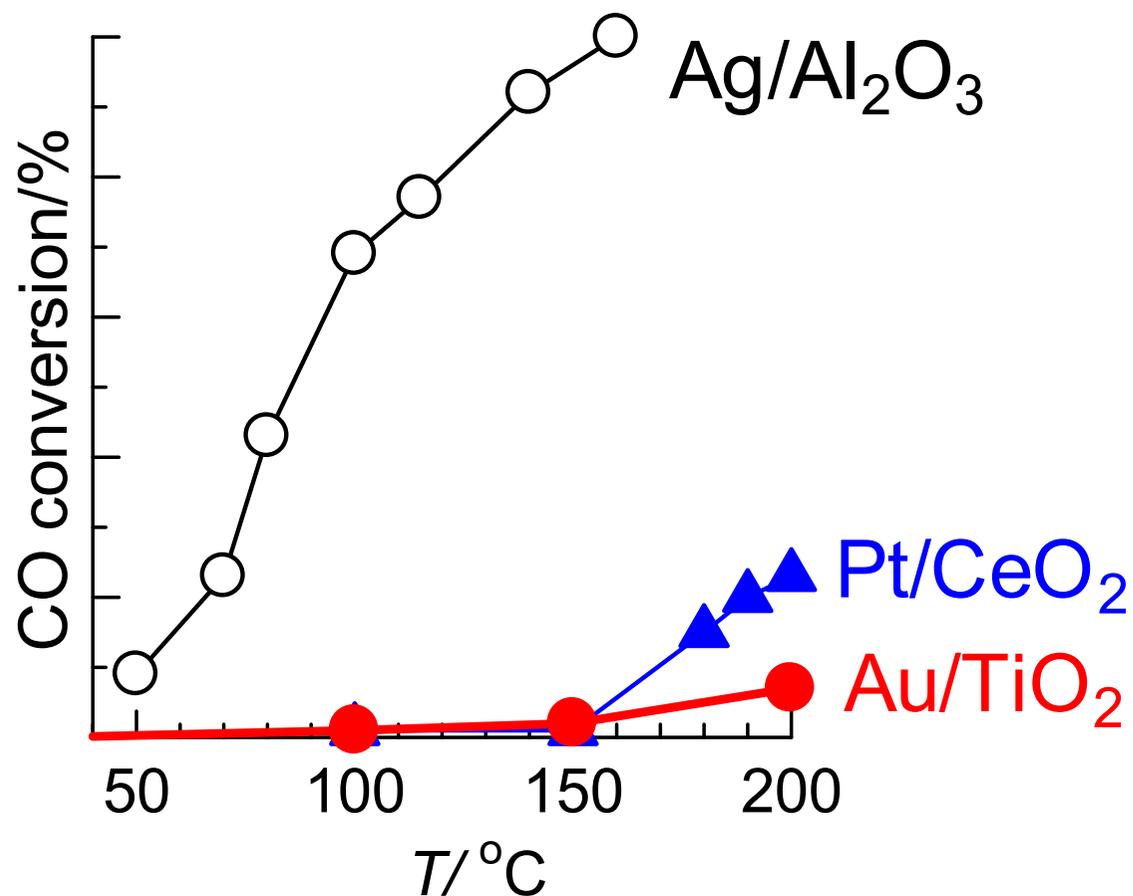


1000°C air



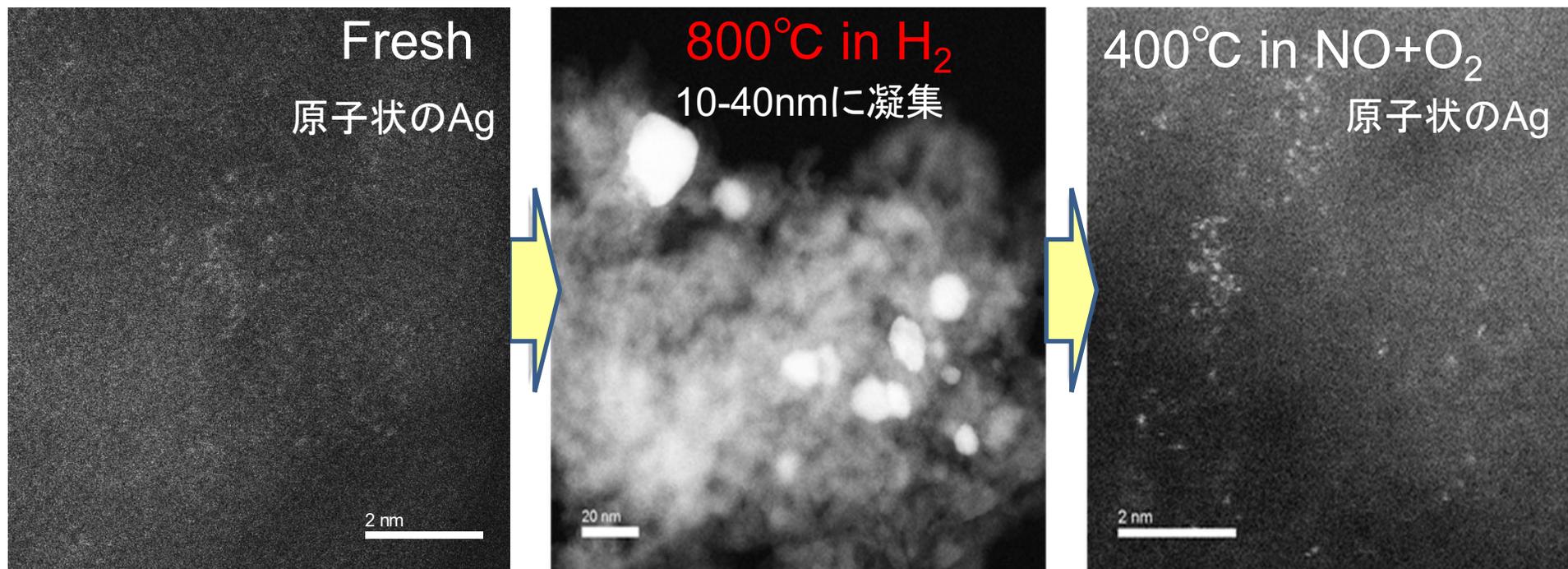
非白金族系の自己再生触媒（初めて）

900°C H₂還元, 1000°C再焼成後

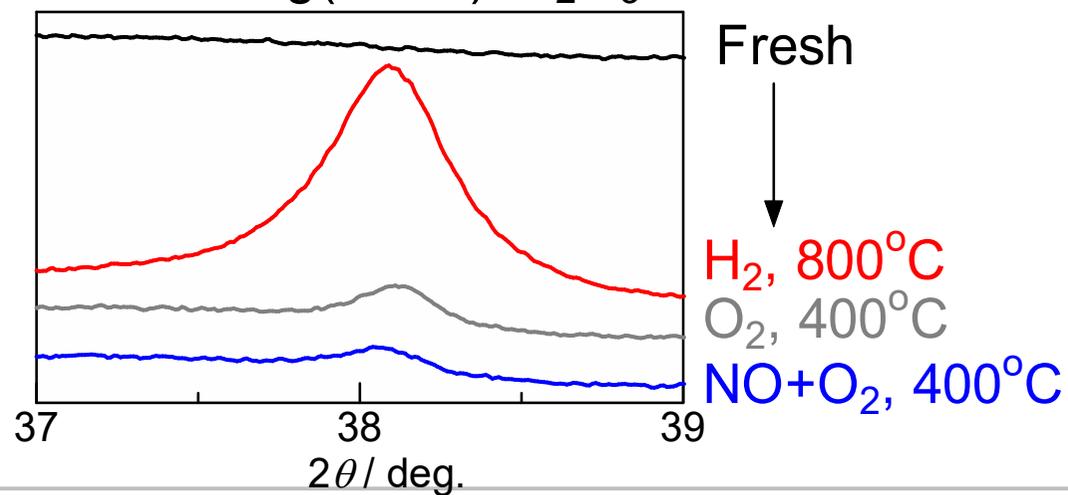


K. Shimizu, *ChemCatChem*, 2010

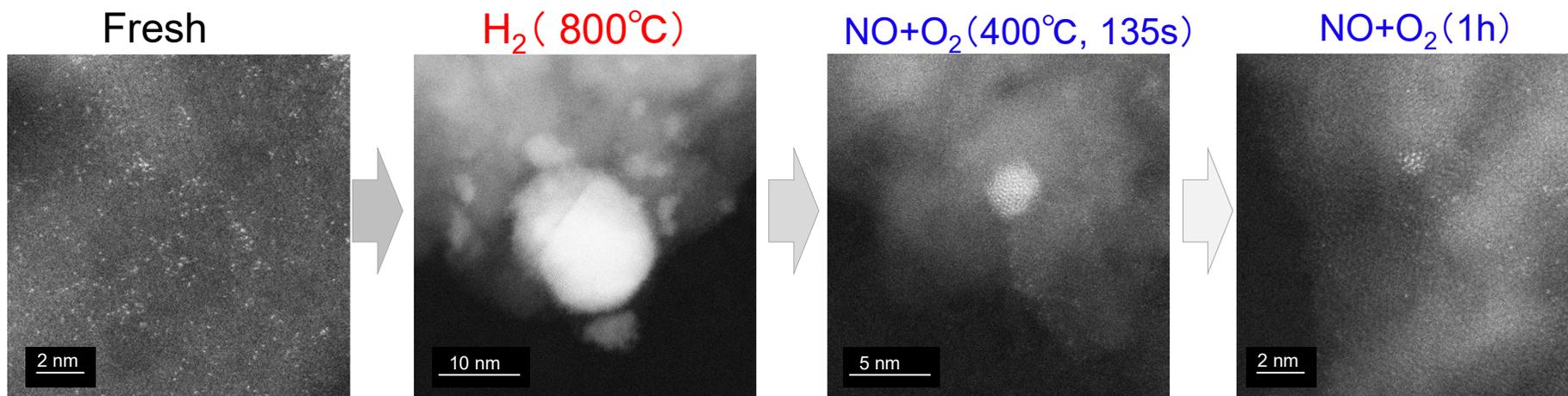
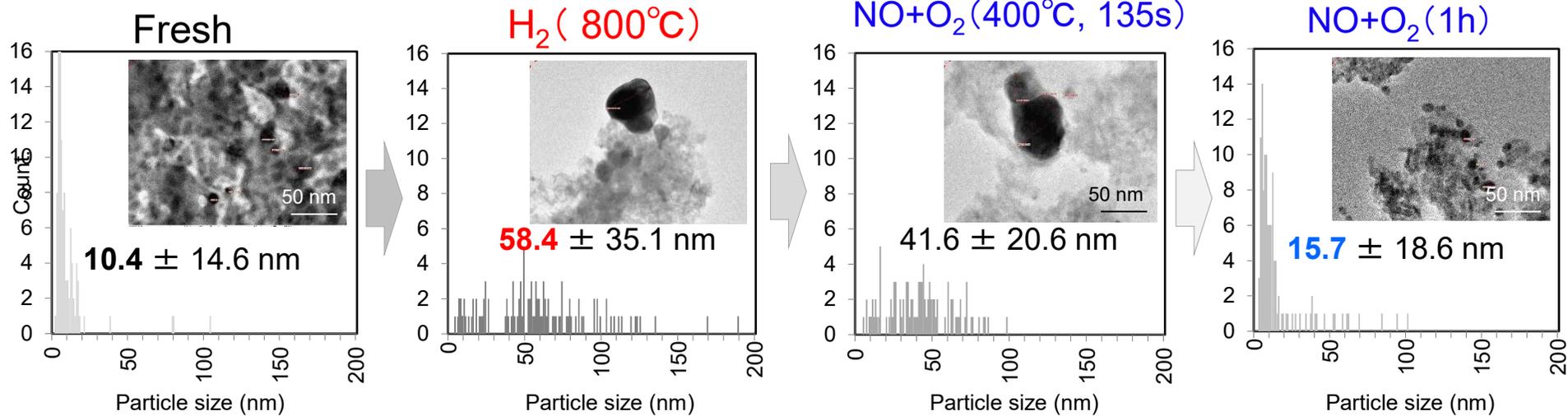
Ag(3wt%)Al₂O₃のSTEM



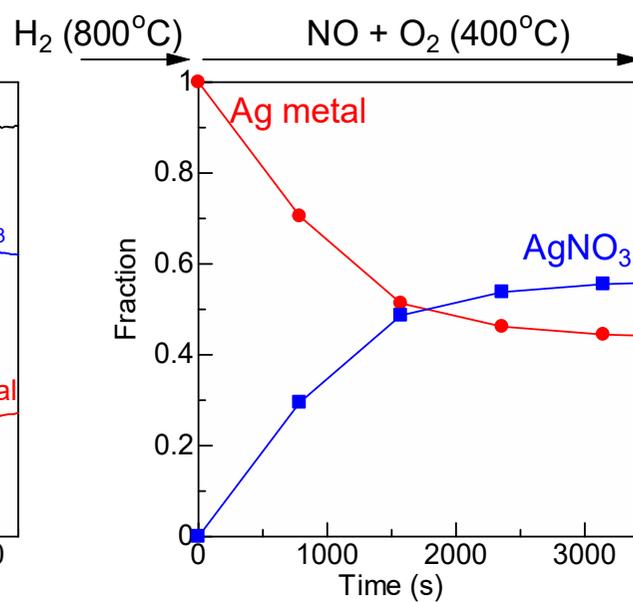
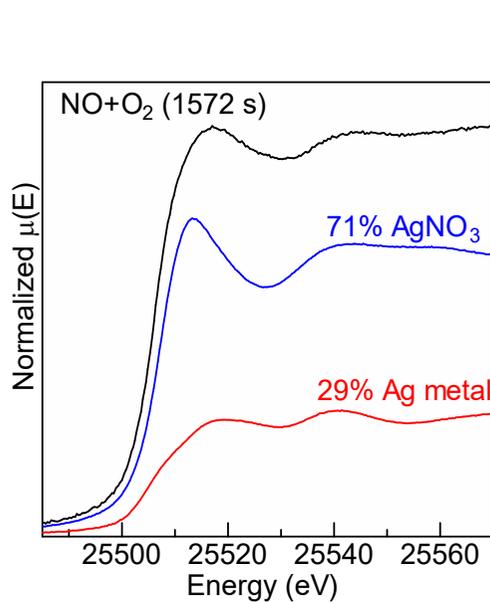
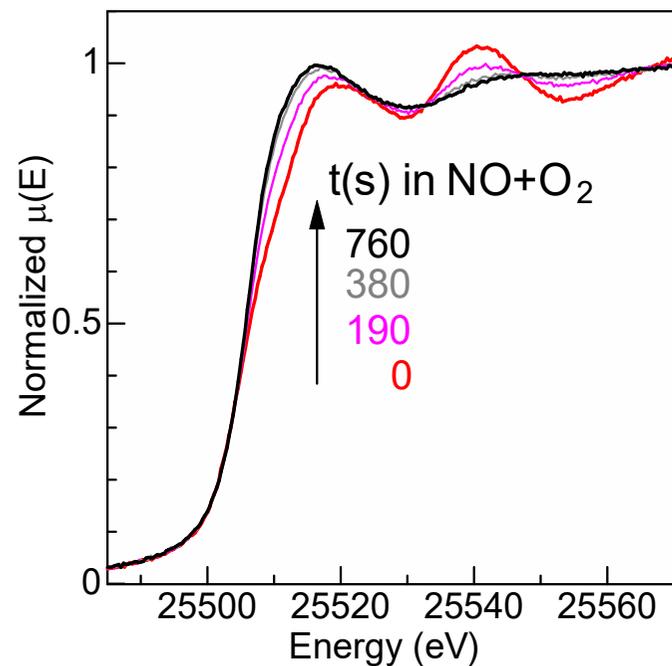
XRD of Ag(3wt%)/Al₂O₃



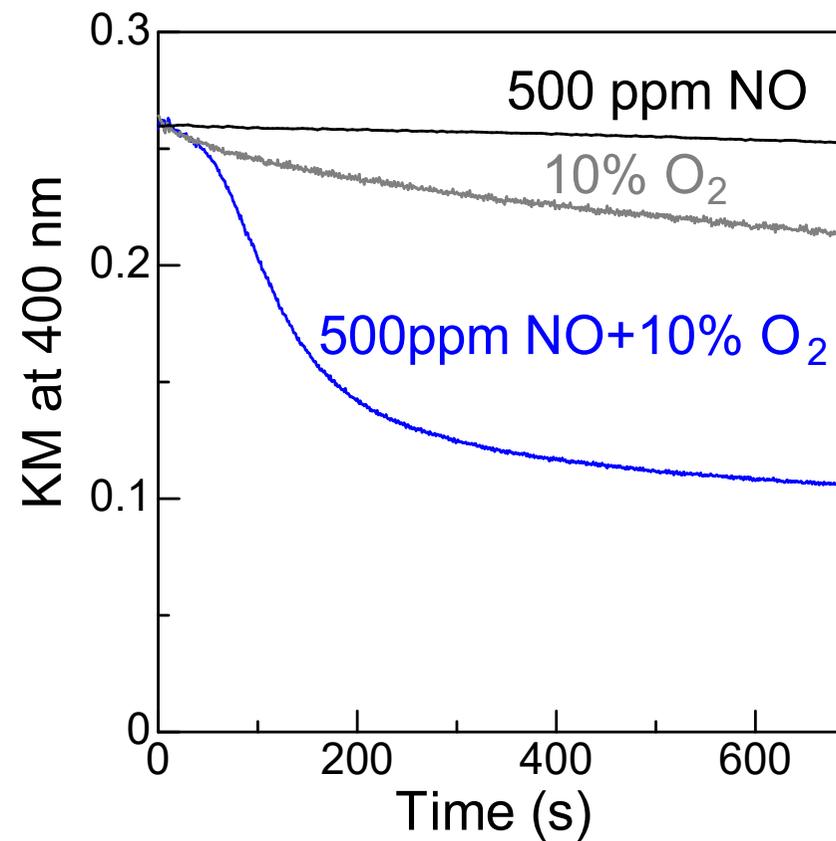
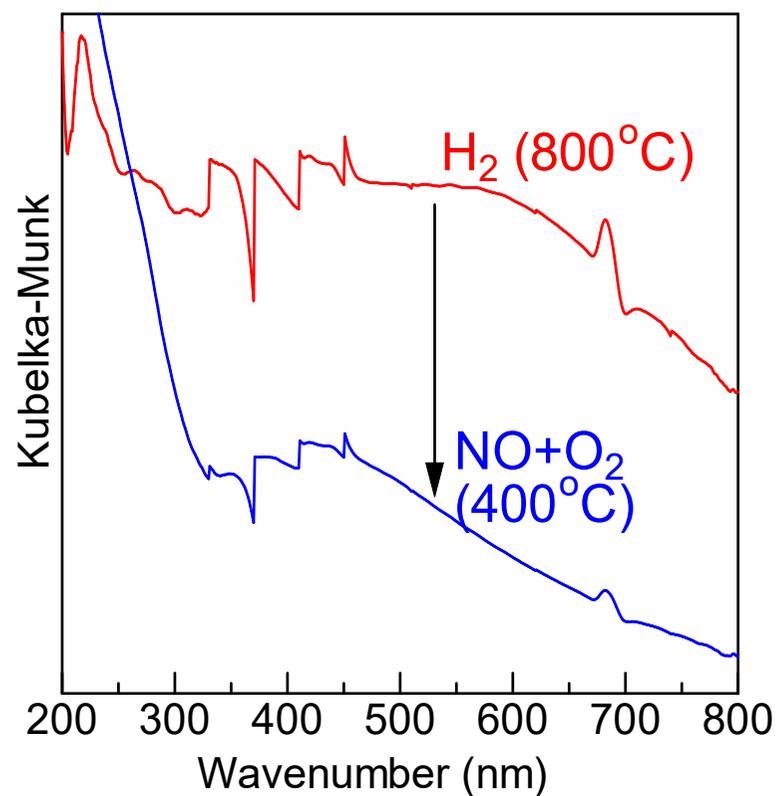
Ag(10wt%)Al₂O₃のTEM, STEM



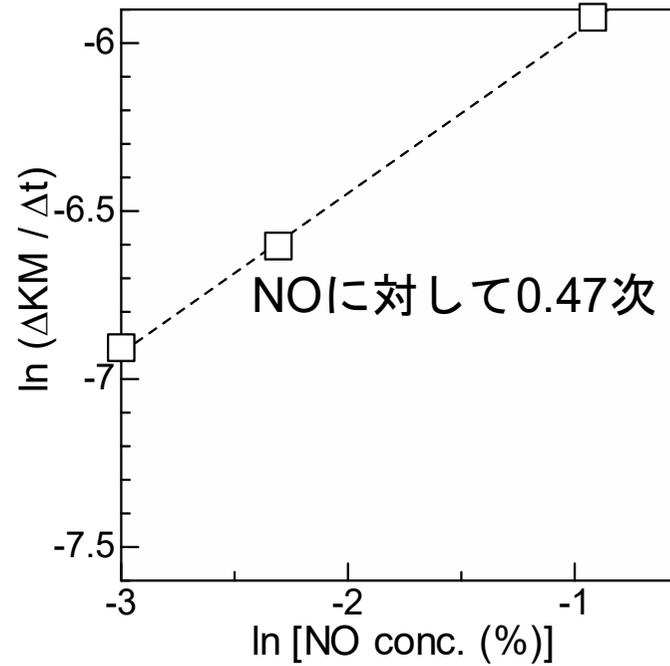
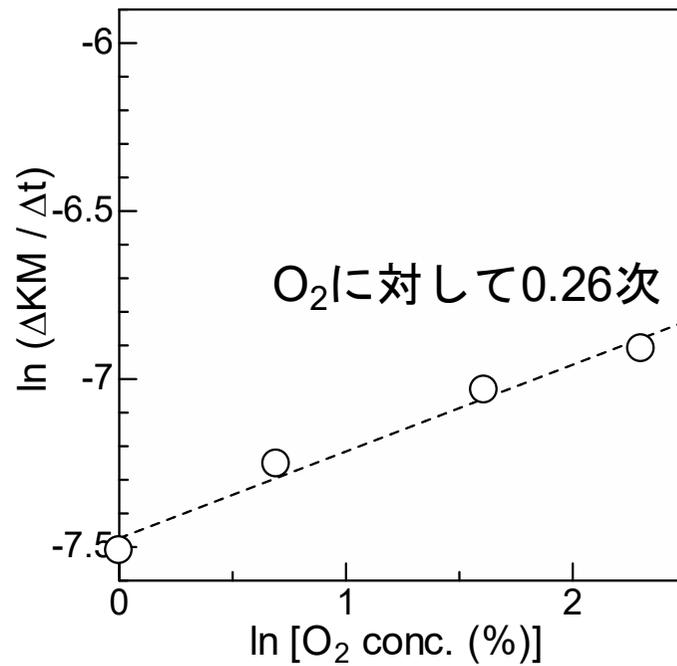
NO+O₂処理中(400°C)のin situ XANES



金属Ag減少速度に対する酸化ガス($\text{NO}+\text{O}_2$, O_2)の影響(in situ UV-Vis)

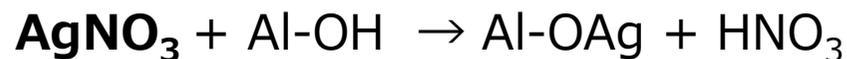
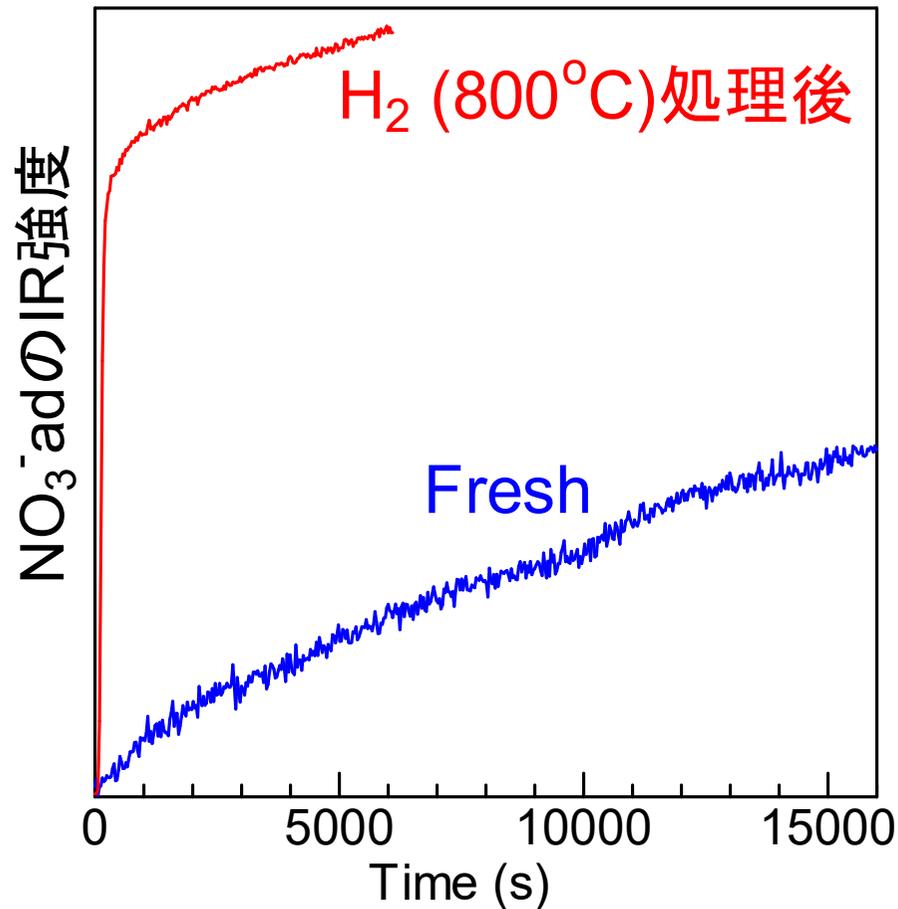


NO+O₂(400°C)中での金属Ag減少速度の分圧依存 (in situ UV-vis)



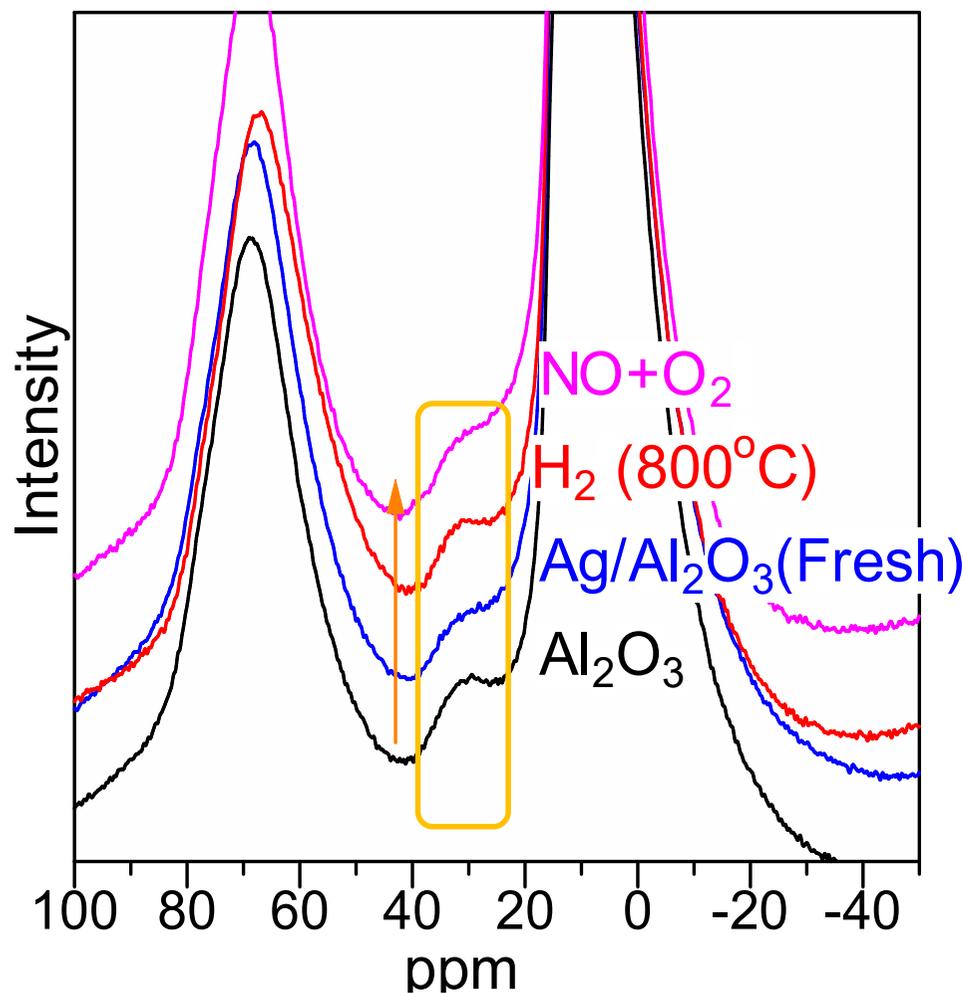
O₂とNOの両方がAg金属粒子のAg⁺への分散に関与する

NO+O₂中のin situ IR (400°C)

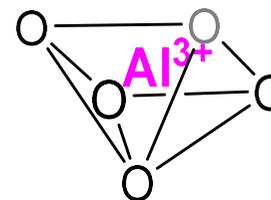


Ag担持→凝集→再分散: Al_2O_3 のアンカーサイトは変化するのか?

^{27}Al -NMR of $\text{Ag}(3\text{wt}\%)\text{Al}_2\text{O}_3$



表面の5配位 Al^{3+} site



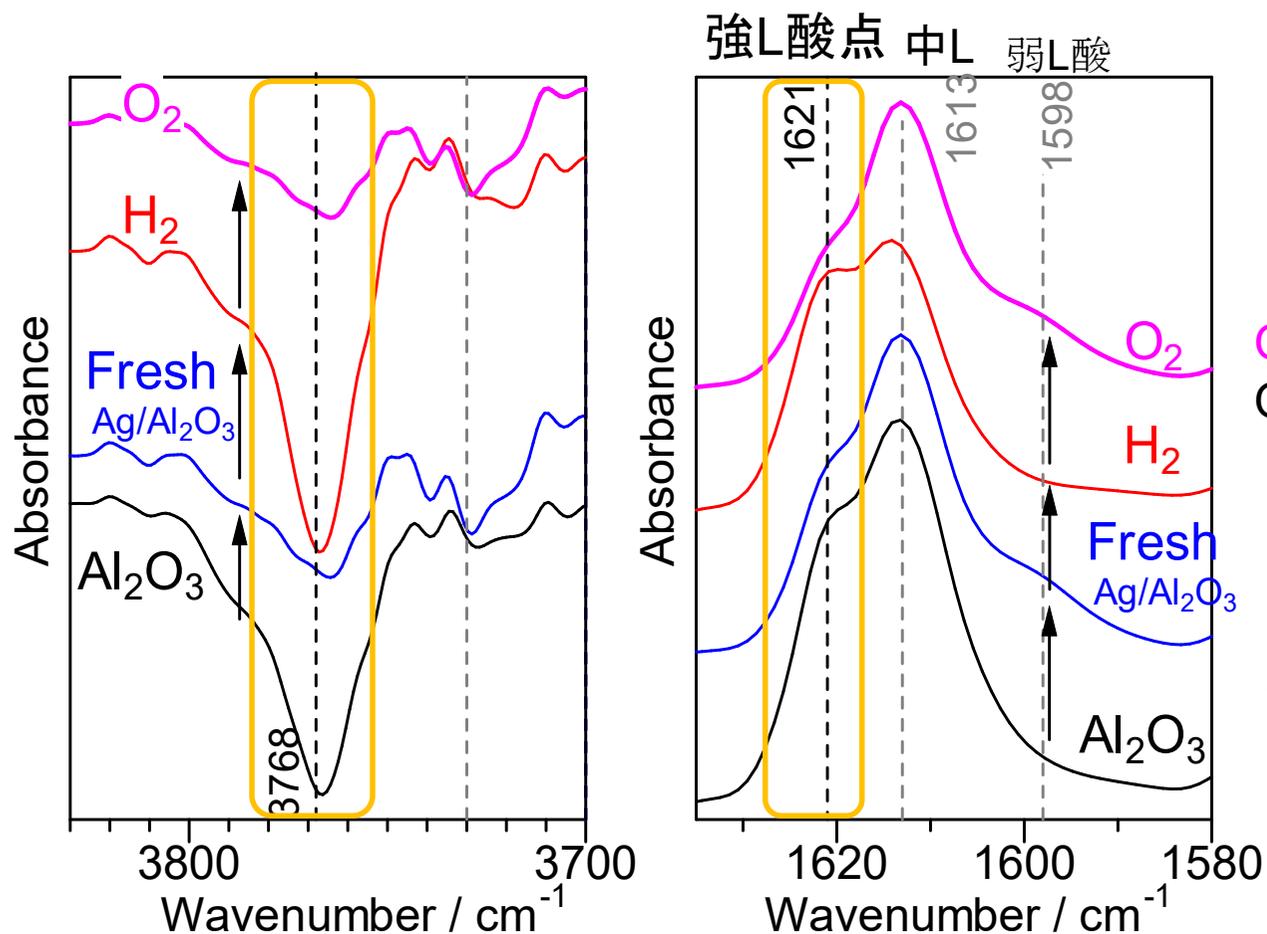
$\text{NO}+\text{O}_2$ 処理で $\text{Al}^{3+}_{\text{penta}}$ のピークが減少

高温還元により $\text{Al}^{3+}_{\text{penta}}$ のピークが増加

Ag担持により $\text{Al}^{3+}_{\text{penta}}$ のピークが減少

Ag担持→凝集→再分散: Al_2O_3 のアンカーサイトは変化するのか?

Pyridine 吸着IR (200°C)

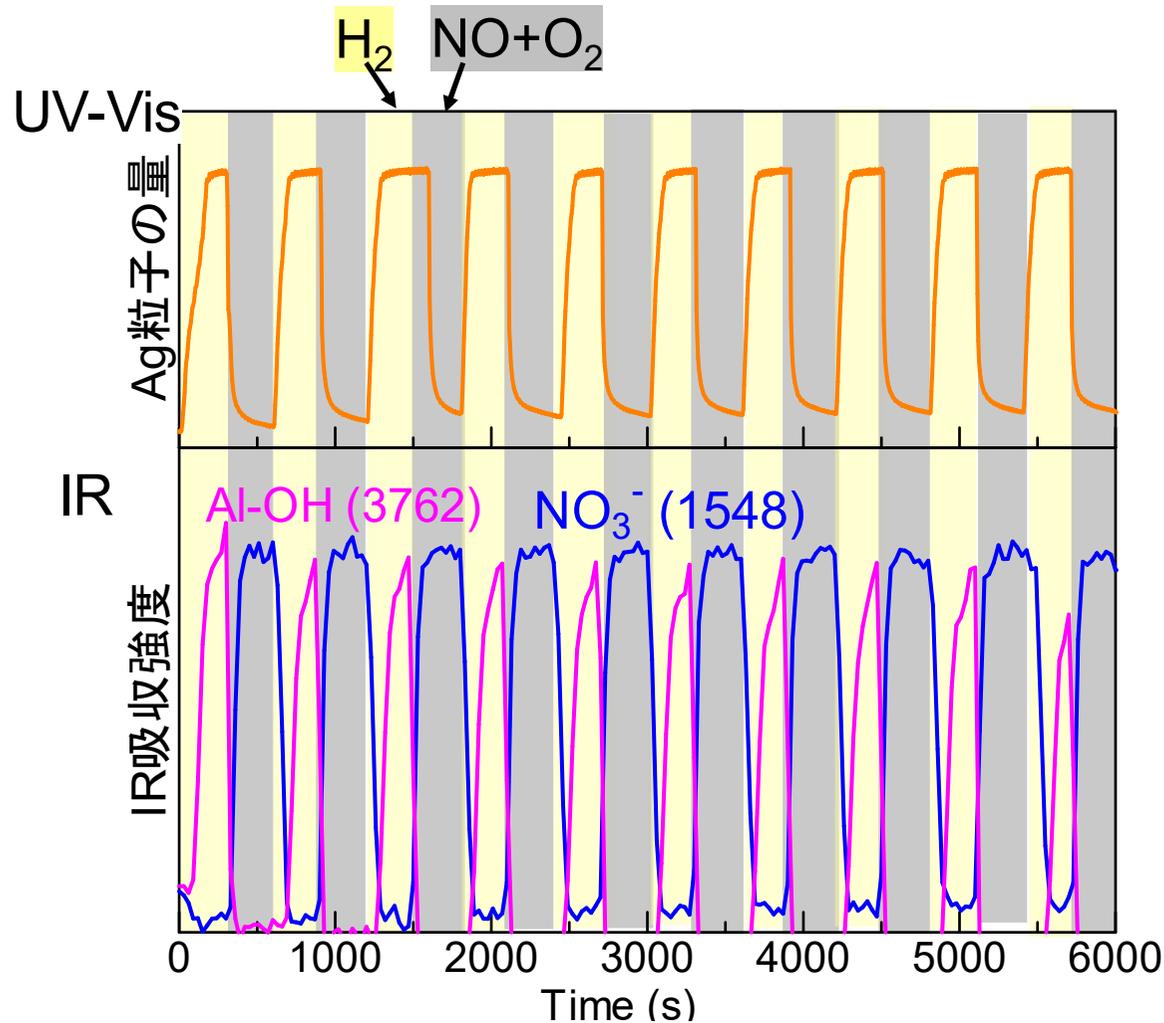


O_2 処理により、
OH基と強いLewis酸点が減少

高温還元により、
OH基と強いLewis酸点が増加

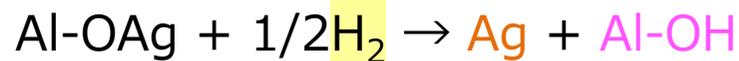
Ag担持により、
OH基と強いLewis酸点が減少

H₂ ⇌ NO + O₂ 交互導入時のin situ UV-vis/MS, IR (600°C)



Agの凝集⇔原子状分散が
可逆的に起こる

- H₂: AlOHが増加
Ag-NO₃⁻が減少
Ag粒子増加
- NO+O₂: AlOHが減少
Ag-NO₃⁻が増加
Ag粒子増加

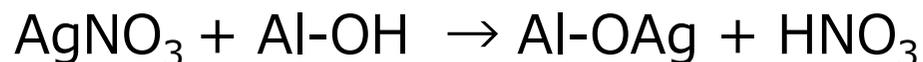


結論: Agの凝集・再分散メカニズム

【凝集】



【分散】



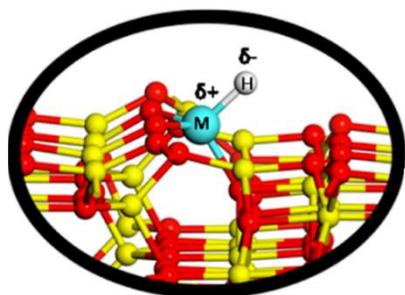
O₂中



CHAゼオライト内Inヒドリドを触媒活性点とする 選択的エタン脱水素反応

安村駿作・前野禅

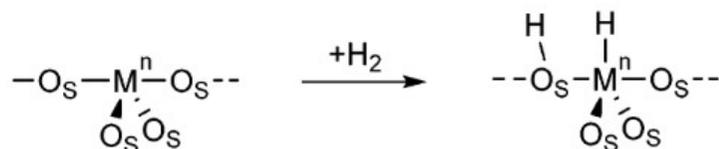
表面金属ヒドリド



- 水素化・脱水素反応の活性点や中間体として作用する
- 不安定性かつ複雑な構造を有する
- 新規ヒドリド種の構造解析と触媒作用解明は未だ困難

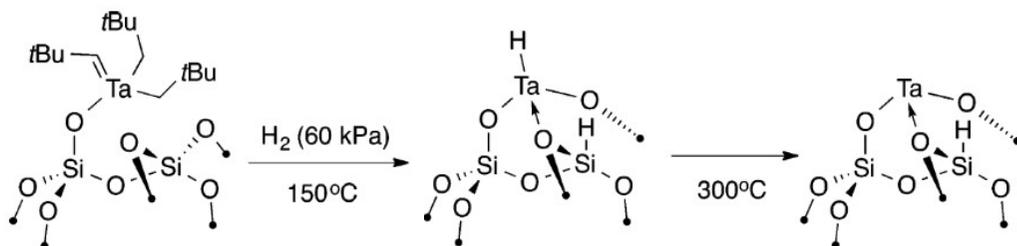
C. Copéret et al.,
Chem. Rev. 2016, 116, 8463–8505

➤ 金属-酸素結合でのH₂の不均等開裂



不均一な固体表面では
ヒドリド種の構造制御が困難

➤ 表面有機金属化学を利用した手法

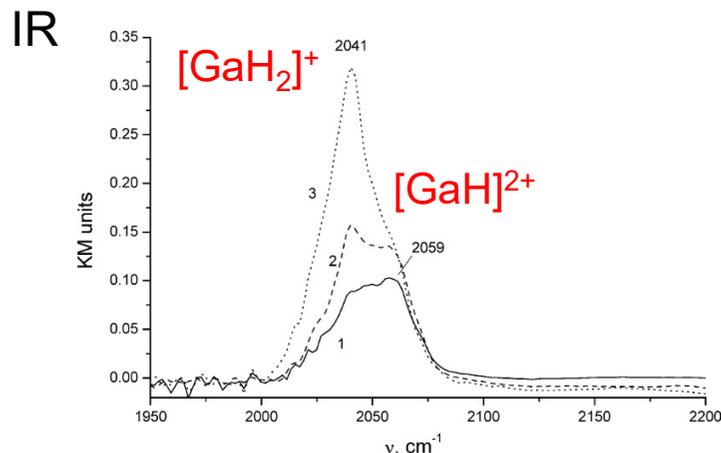


均一なヒドリド種が生成
高温では不安定

高温で生成・機能する表面金属ヒドリド種の触媒作用は未開拓

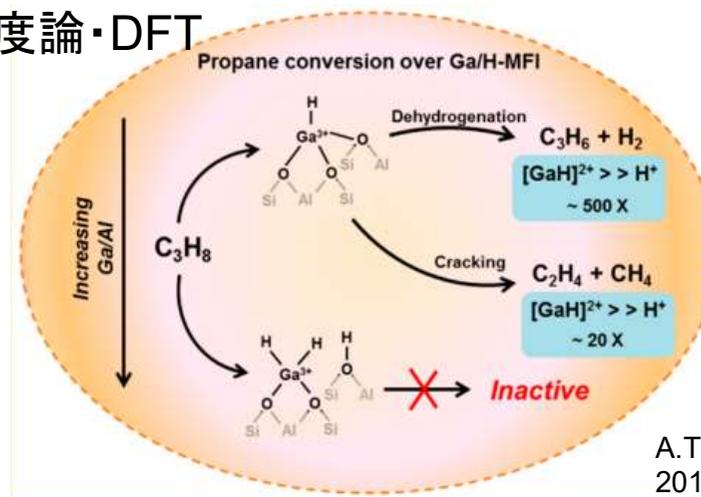
Ga,In-ゼオライトによる低級アルカン活性化

- Ga-ゼオライト: プロパン脱水素の活性種は $[\text{GaH}]^{2+}$



E.J.M. Hensen et al., *J. Catal.*, 2004, 227, 263

速度論・DFT



A.T. Bell et al., *J. Am. Chem. Soc.*
2019, 141, 1614

J. A. Lercher, *J. Am. Chem. Soc.*
2018, 140, 4849

- In-ゼオライト

$[\text{InO}]^+$ を活性点とする CH_4 -SCR

E. Kikuchi et al., *Catal. Today*, 1994, 22, 73-86

In^+ 触媒による CH_4 変換

T. Baba et al., *J. Phys. Chem. B*, 2005, 109, 4263-4268

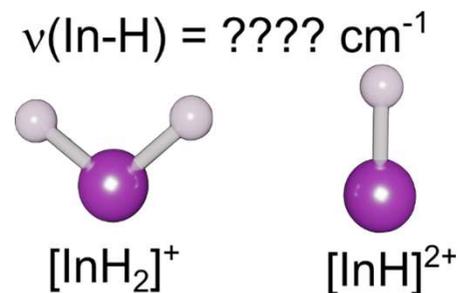
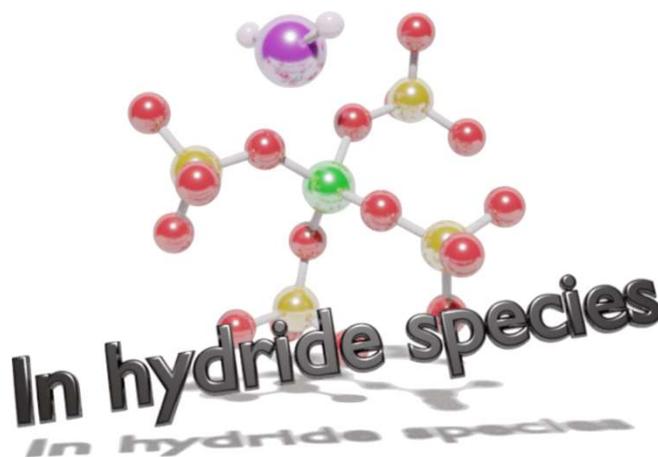
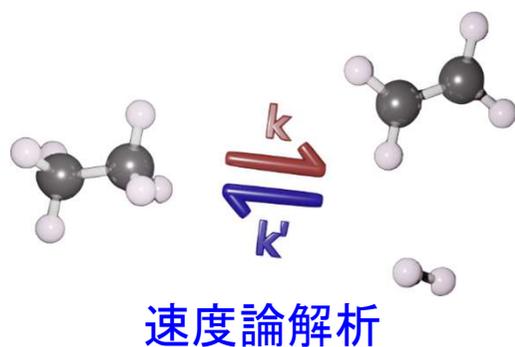
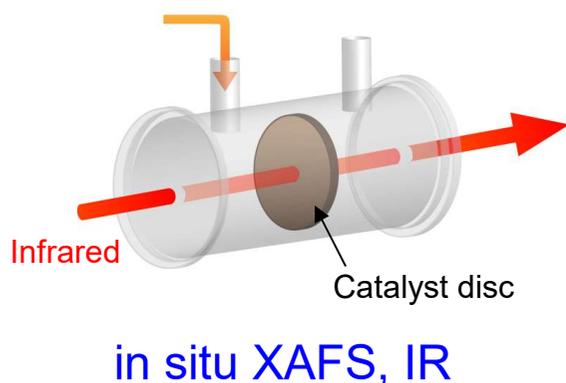
In-oxo 種による低温 CH_4 活性化

Z. Maeno, et al., *Phys. Chem. Chem. Phys.*, 2019, 21, 13415-13427

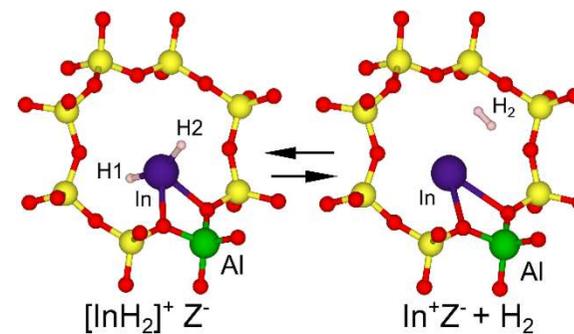
Inヒドリドの報告例はない

本研究

In-CHAのエタン脱水素の活性種・反応機構を**実験**・**理論**により研究



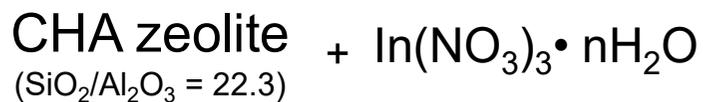
振動数解析



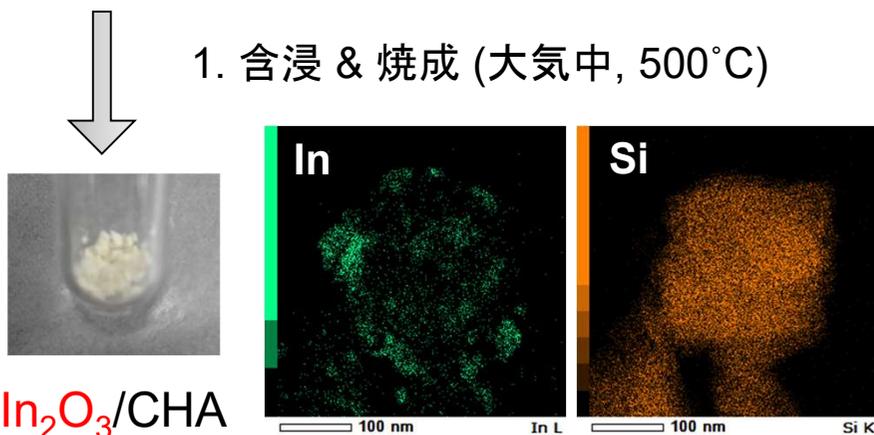
遷移状態計算

触媒調製

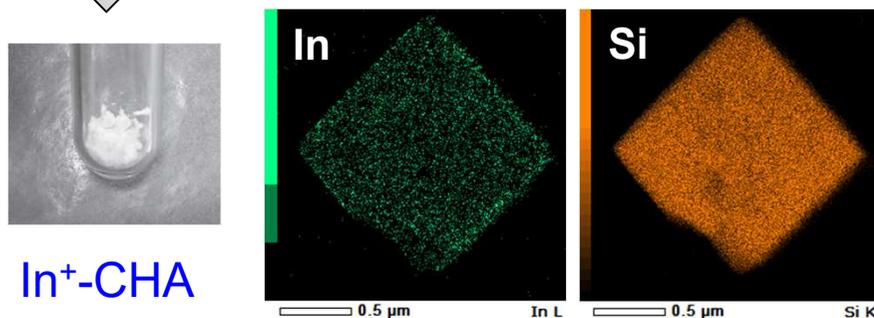
➤ Synthesis



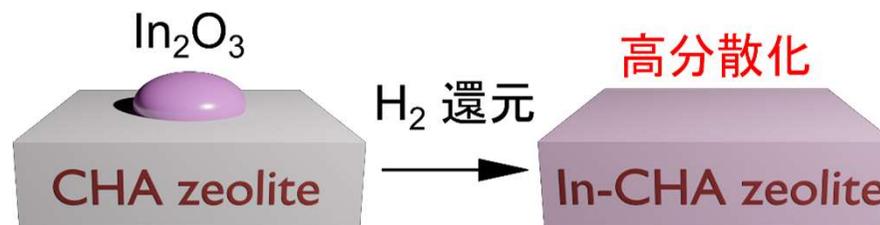
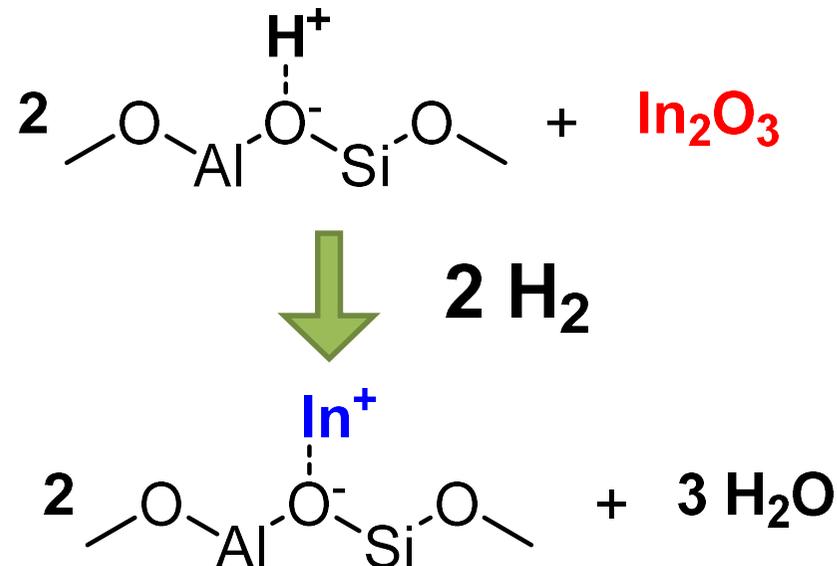
1. 含浸 & 焼成 (大氣中, 500°C)



2. H_2 還元処理 (500 °C)

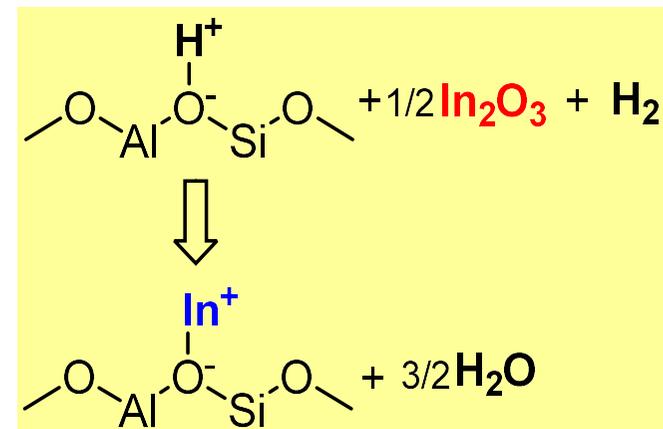
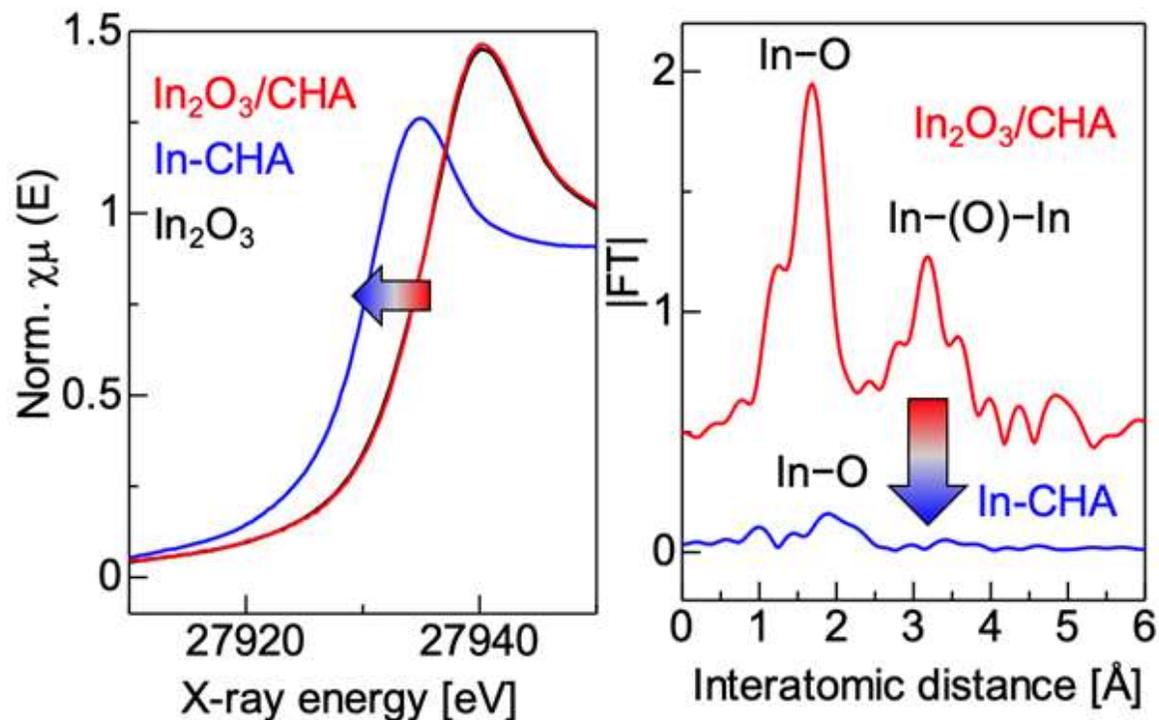


還元的固相イオン交換

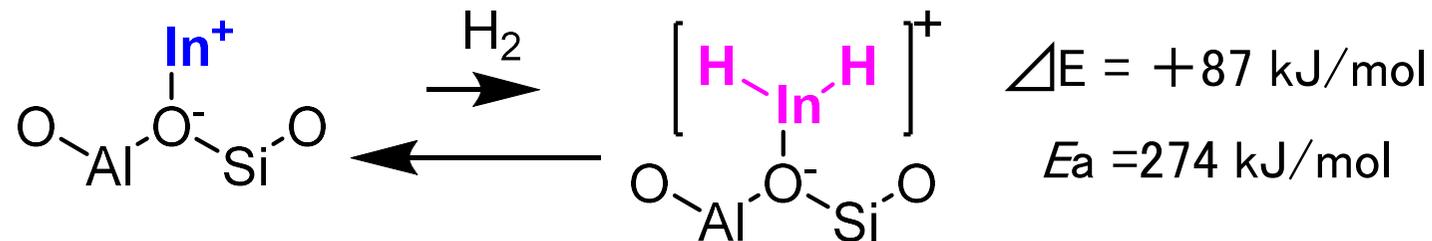


In 種がゼオライト内に高分散化

還元前後のIn K-edge XAFS



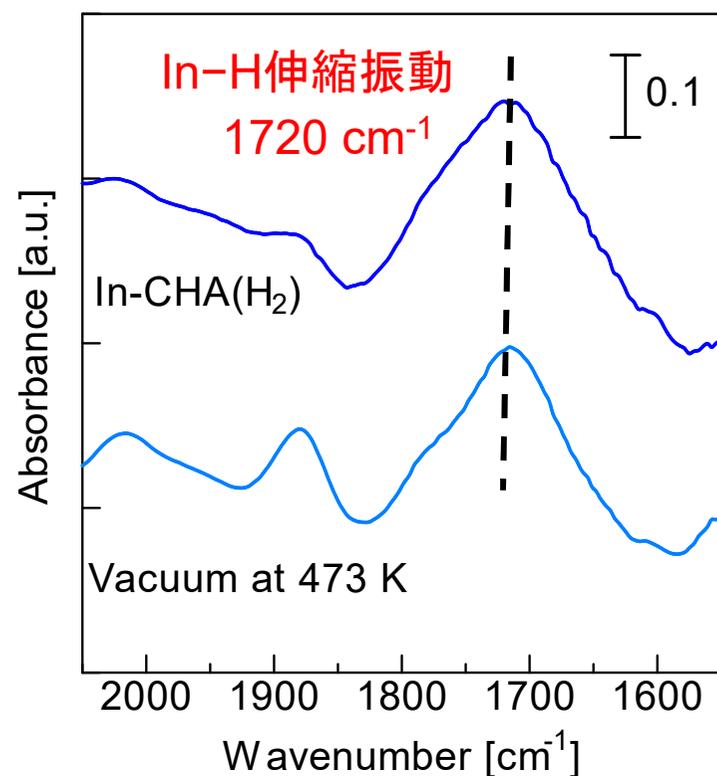
DFT



高温、H₂雰囲気中、ごく一部のInはヒドリド種になるはず！
IRで実測してみよう！

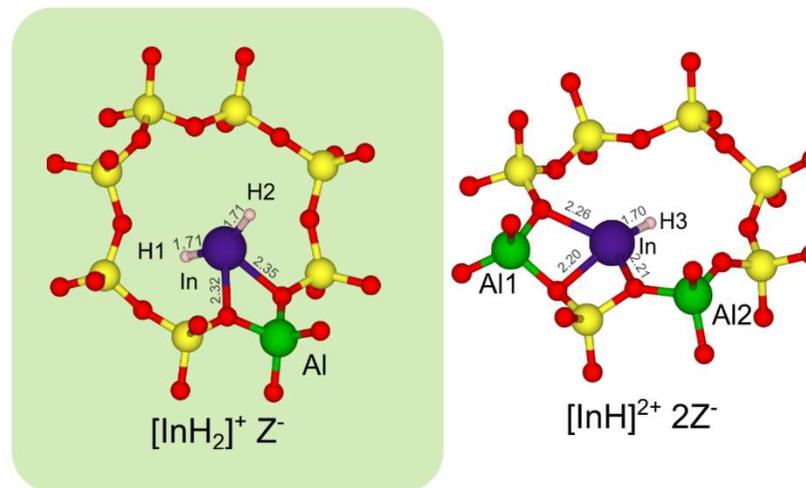
In⁺-CHA, 500°C水素処理後の低温IR (-100°C)

➤ 実験手順



➤ 振動数のDFT計算

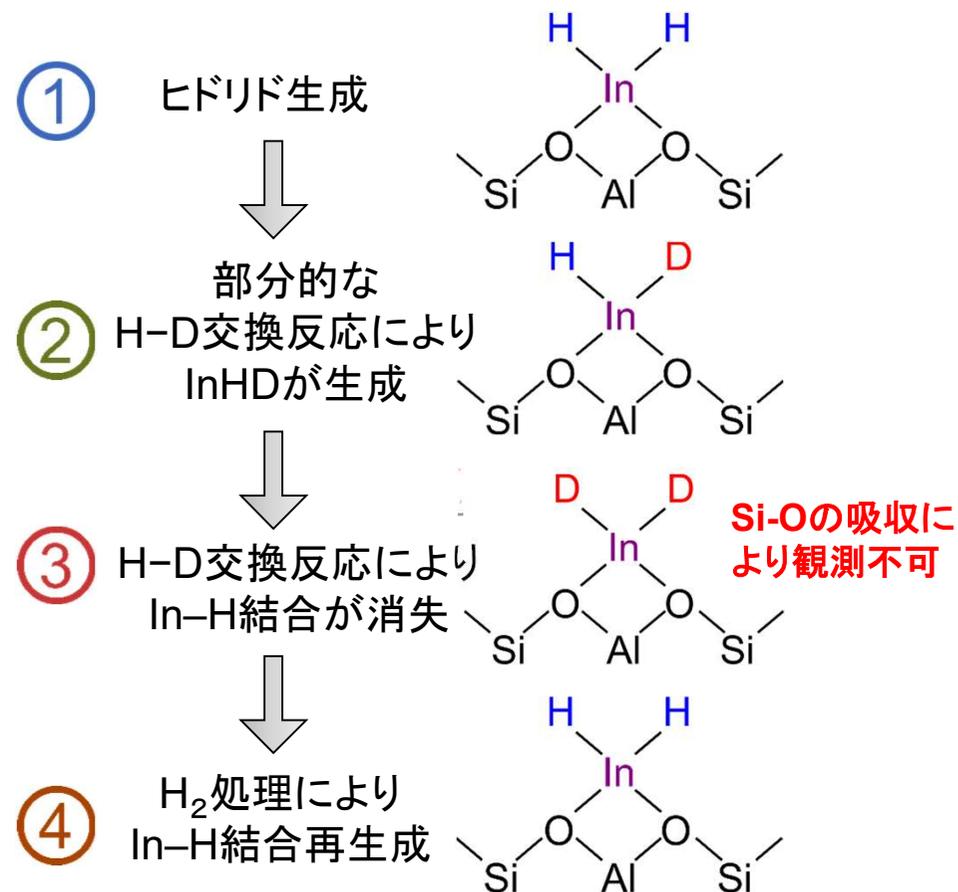
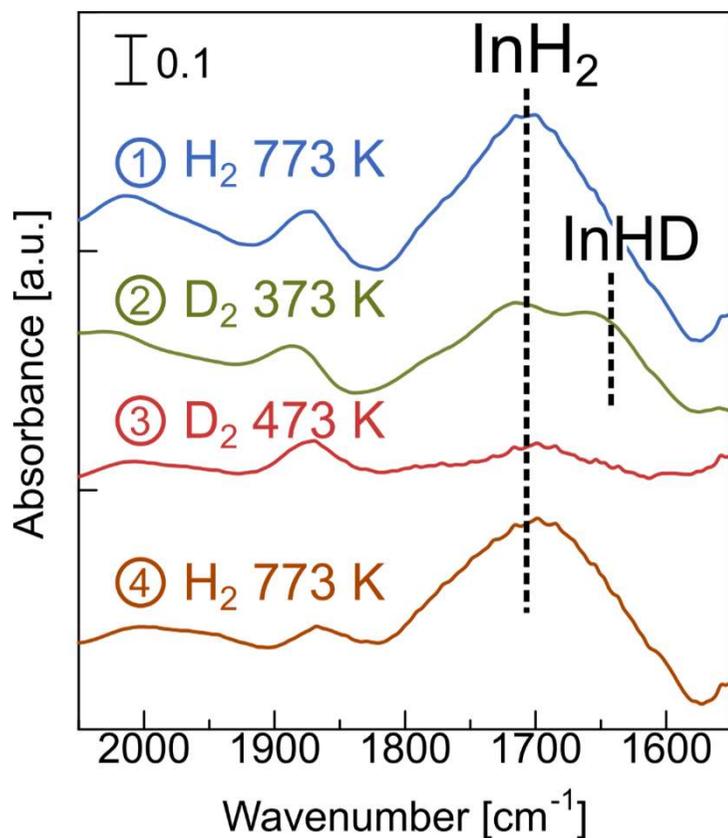
Alサイト	[InH ₂] ⁺ (対称伸縮振動)	[InH] ²⁺
Single 1Al site	1735.6	-
Paired Al site	1721.2	1793.0



[InH₂]⁺Z⁻が実験値に近い

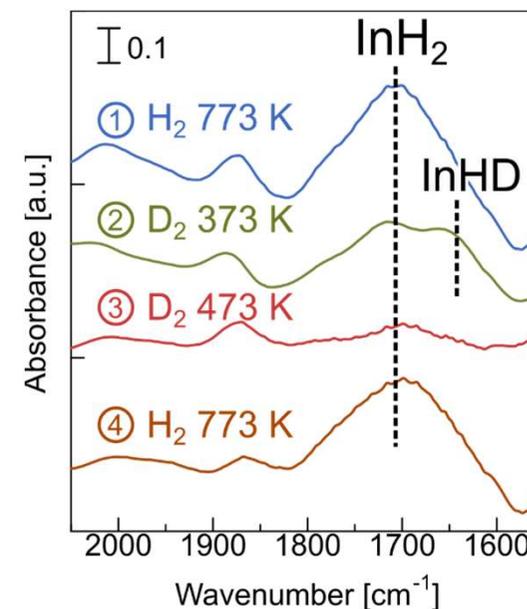
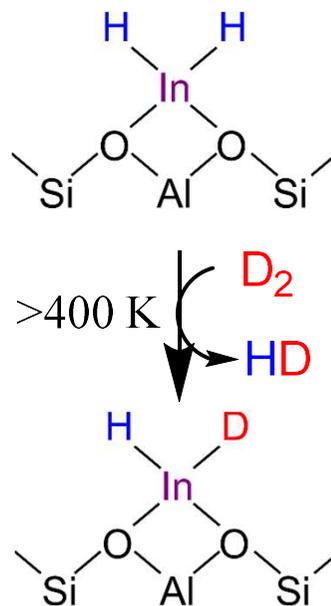
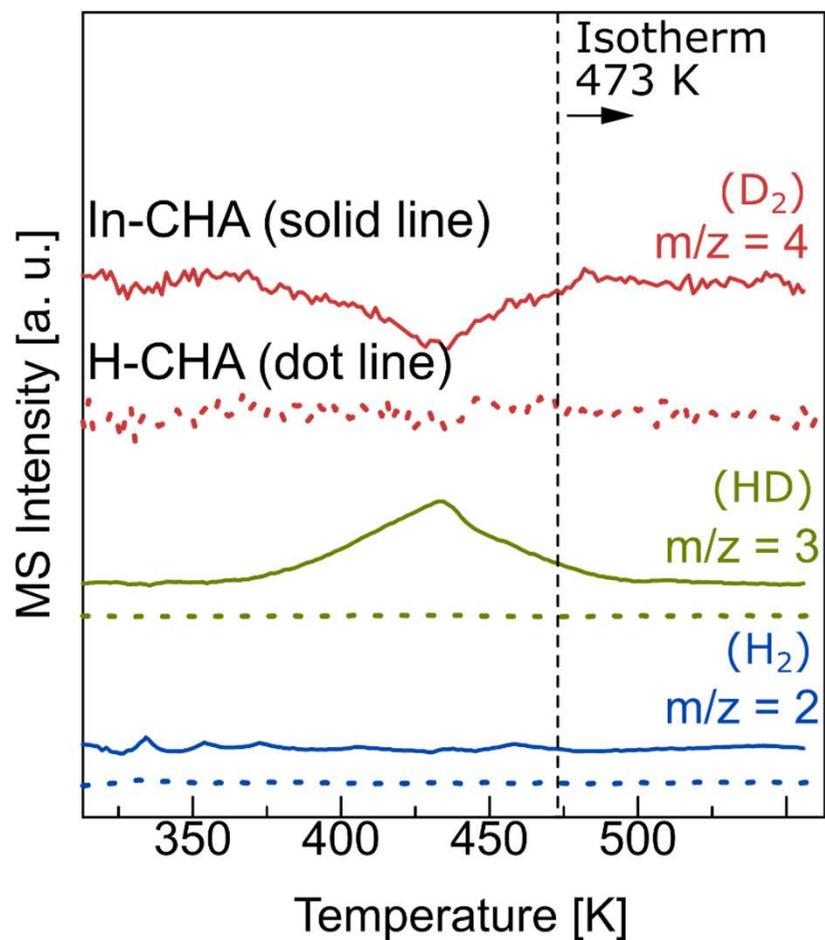
[InH₂]⁺は新規化学種なので、更に確認をすべし！

InヒドライドにD₂を曝すと(H-D交換のIR観察)



IRの帰属は[InH₂]⁺で正しそう

D₂中で昇温した後の出口ガス分析



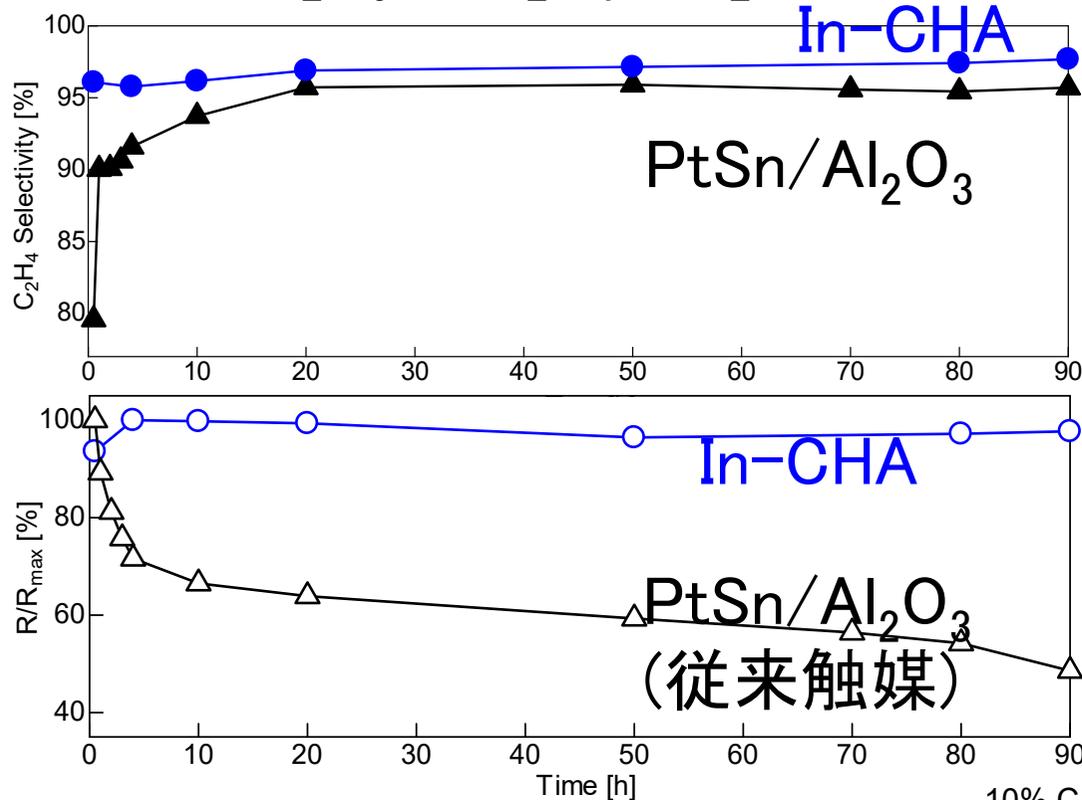
【結論】 CHA中のInヒドリドの構造は[InH₂]⁺である

エタン脱水素 (600°C)

※工業法は無触媒、高温(>800°C)での熱分解を採用



C_2H_4
選択率
(%)



【利点】

- ✓ 高選択性
(過剰脱水素しない)
- ✓ 劣化しない
- ✓ 非白金

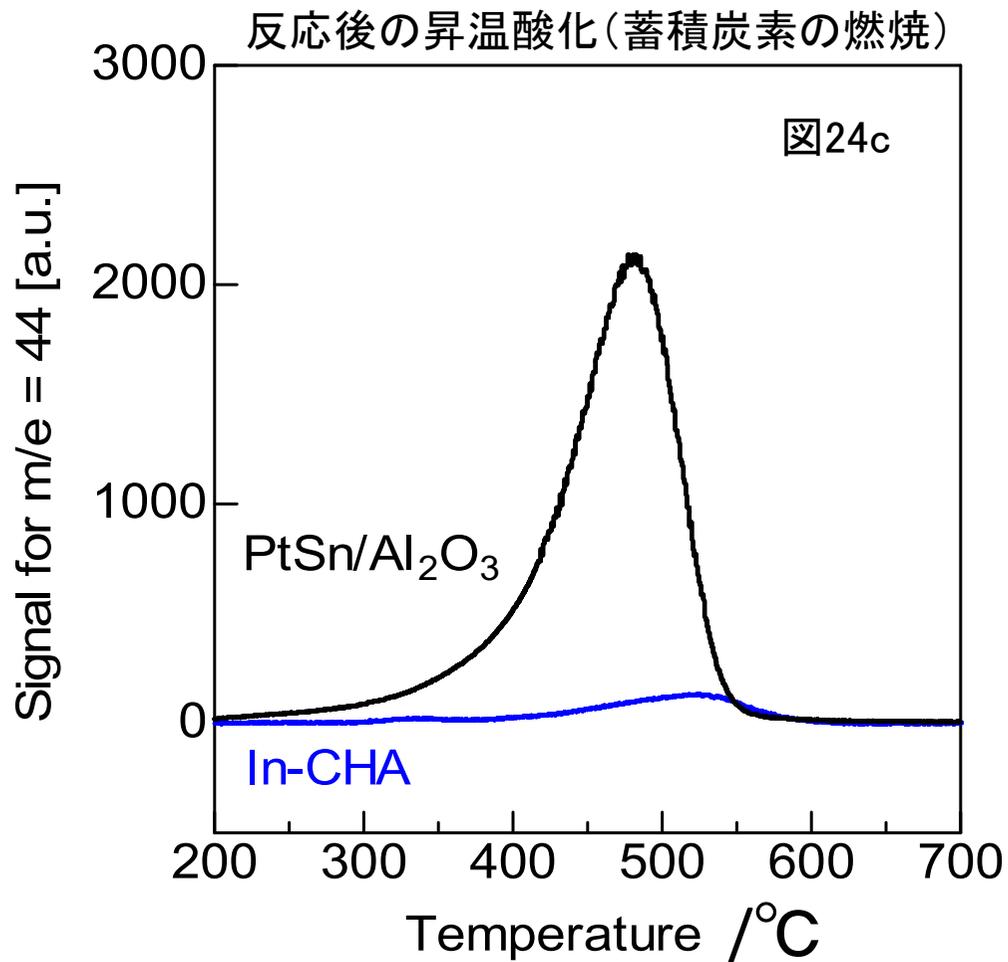
10% C₂H₆/He (10 ml/min), 触媒量: 100 mg

In-CHAは炭素析出しにくい

PtSn/Al₂O₃

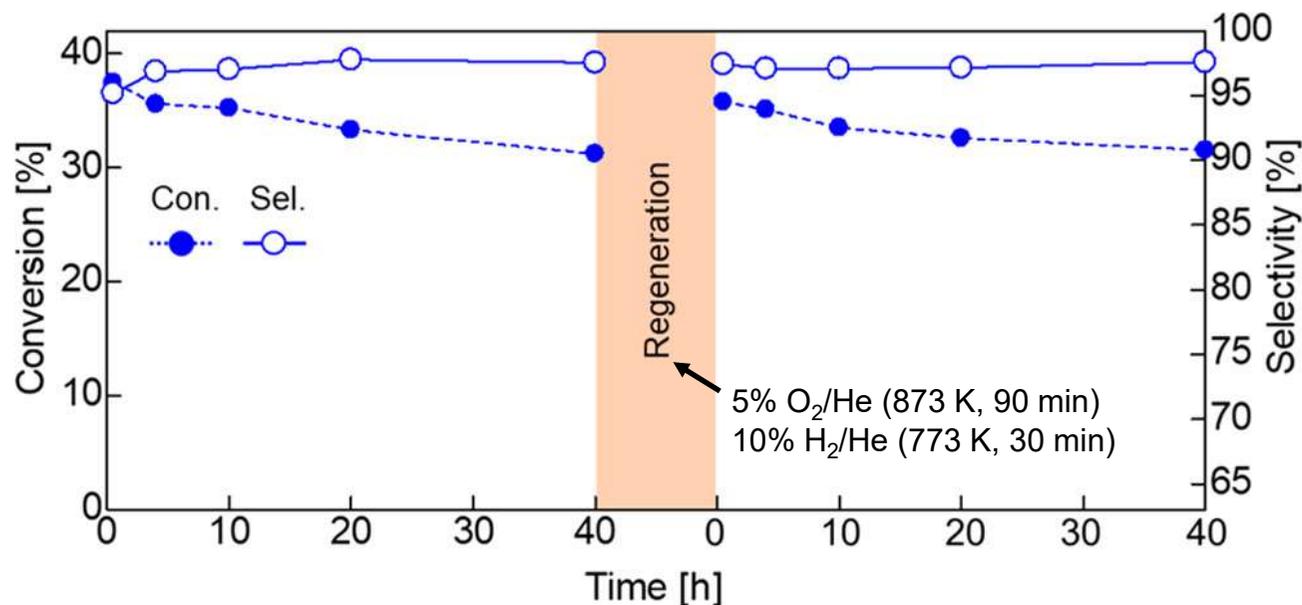


In-CHA



Ptは炭素燃焼(再生)時にシンタリング、劣化

高転化率条件での連続反応・再生

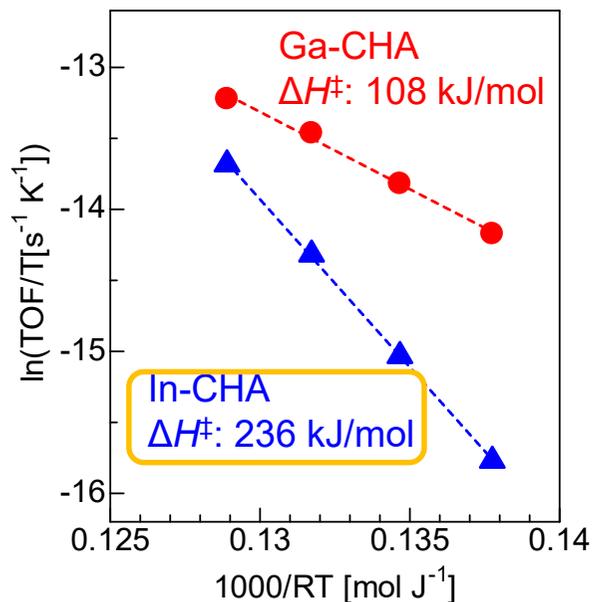


➤ 既報触媒との比較

触媒	濃度 [%]	温度 [K]	転化率 [%]	選択性 [%]	失活速度 [h ⁻¹]	再生	Reference
In-CHA	13	973	37.4	95.1	0.007	○	This work
Cr/SBA-15/Al ₂ O ₃ /FeCrAl	33	1023	47.4	86.9	0.002	×	Energy Fuels 2008, 22, 3631
Ga/SiO ₂ -doped TiO ₂	3	923	46.0	84.9	0.809	○	Fuel Process Tech. 2018, 246
Ni ₃ Ga/Al ₂ O ₃	10	873	10.0	94.0	0.017	○	ACS Catal. 2019, 9, 10464
PtSn-MgGaAlO	20	873	32.1	99.2	0.530	×	RSC Adv. 2017, 7, 22836
Pd-In/SiO ₂	5	873	15.0	100	0.289	×	Catal. Sci. Tech. 2016, 6, 6965

実験・理論による活性化障壁の比較

➤ アイリングプロット



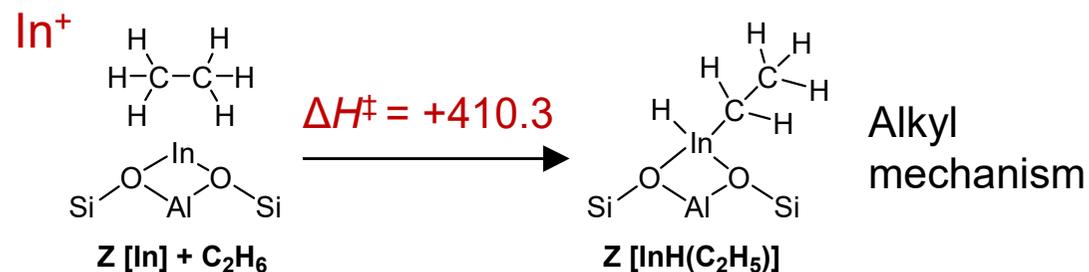
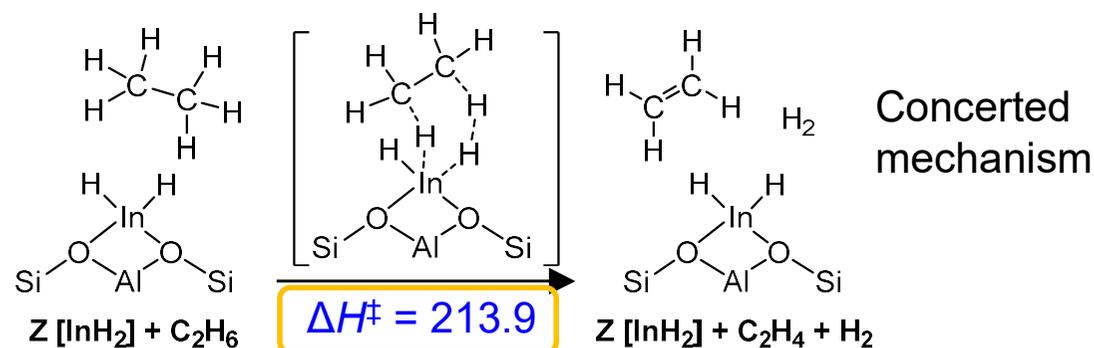
➤ 同位体効果 (933 K)

$$k(\text{C}_2\text{H}_6)/k(\text{C}_2\text{D}_6) = 1.77$$

→本反応の律速はC-H開裂

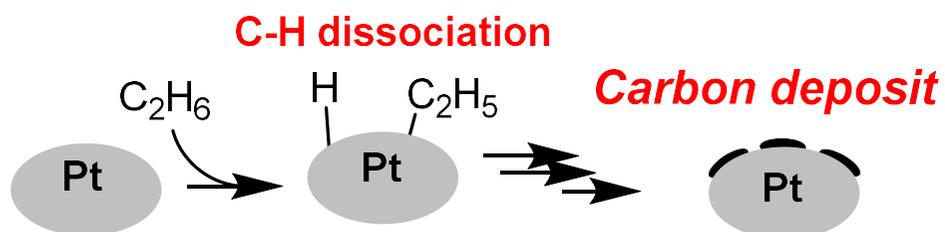
➤ C-H開裂の遷移状態計算 (Unit: kJ/mol)

$[\text{InH}_2]^+$

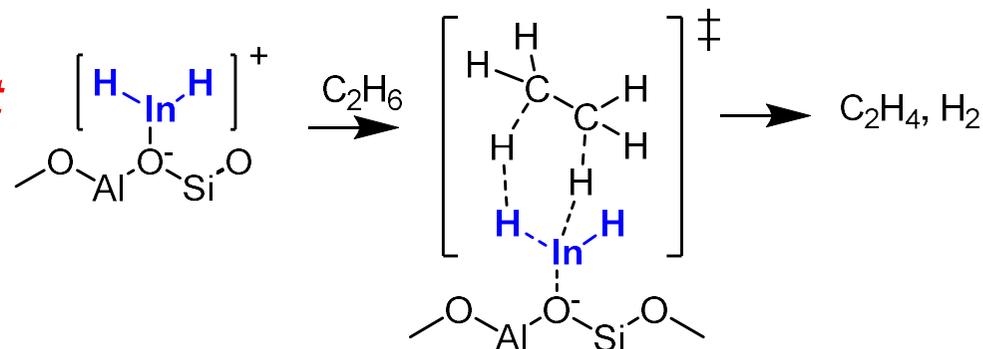


まとめ

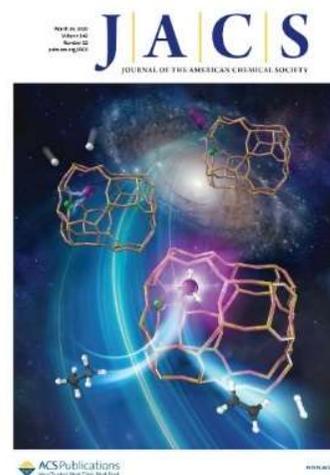
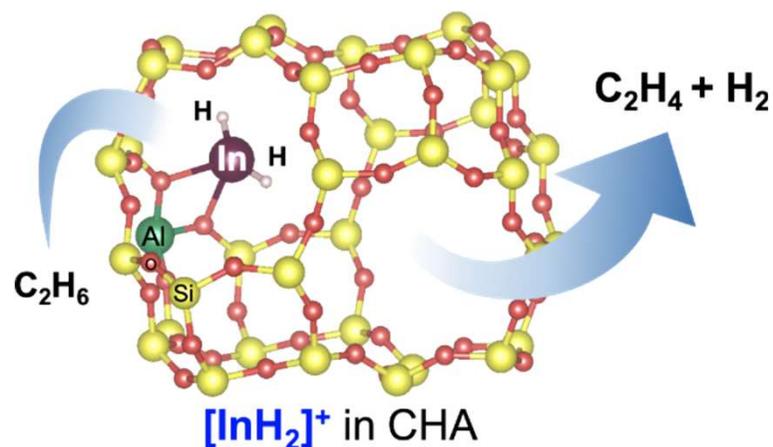
従来触媒 (Pt)



In-CHA



In触媒は、過度のC-H解離による炭素生成を原理的に起こさない



Highlighted
in Front Cover

Maeno, *J. Am. Chem. Soc.*, 2020